



総研大



ILC-TPC用高開口度GEM型ゲート装置を 搭載したTPC読み出しモジュールのビーム試験

青木優美(総研大/KEK)

2017.3.18, 日本物理学会 第72回年次大会@大阪大学

青木 優美(総研大), 小川 智久(総研大), 庄司 愛子(岩手大), 藤井 恵介(KEK), 与那嶺 亮(CEA), 杉山 晃(佐賀大), 房安 貴弘(佐賀大), 加藤 幸弘(近畿大), 池松 克昌(東北大), Paul Colas(CEA), Serguei Ganjour(CEA), Ralf Diener(DESY), Oliver Schäfer(DESY), 川田 真一(DESY), Felix Müller(DESY), Leif Jönsson(Lund Univ.), Ulf Mjörnmark(Lund Univ.), Huirong QI(IHEP), 木原 大輔(Siegen Univ.), 小林 誠(KEK), 松田 武(KEK), 成田 晋也(岩手大), 根岸 健太郎(岩手大), 高橋 徹(広島大), 渡部 隆史(工学院大), Ronald Dean Settles(MPI Munich), Junping Tian(東大), 荒井 大輔(フジクラ), 他 LCTPC collaboration

ILC-TPC用高開口度GEM型ゲート装置を 搭載したTPC読み出しモジュールのビーム試験

ILC実験



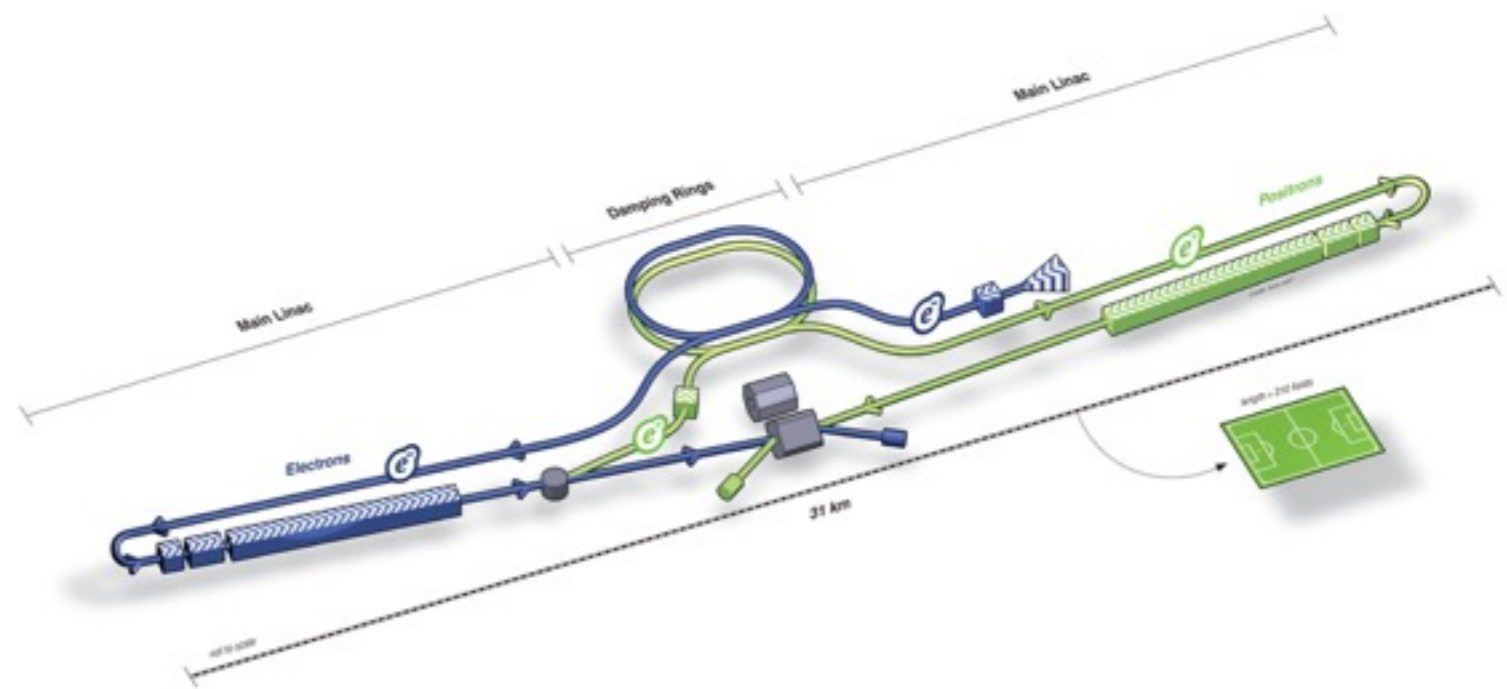
International Linear Collider (国際リニアコライダー) (国際) (直線) (衝突型加速器)

電子と陽電子を世界最高エネルギー (250~500 GeV) で衝突させる

↓
電弱対称性の破れの謎を解明し標準理論を超える新しい物理へ

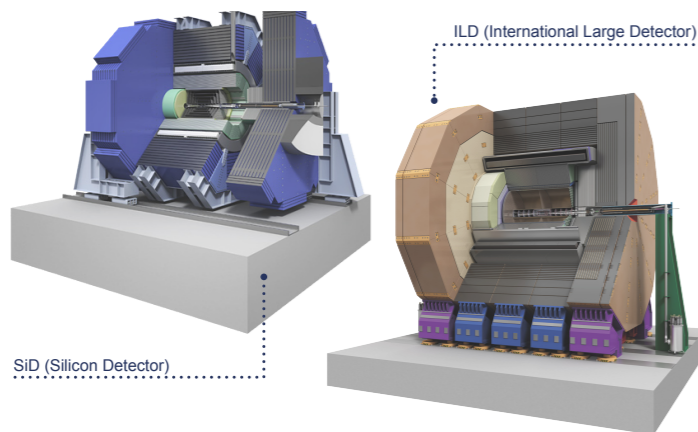
建設候補地：北上山地周辺

ILC実現に向けた最終段階
加速器・検出器の詳細設計



<http://www.linearcollider.org/images/>

SiD

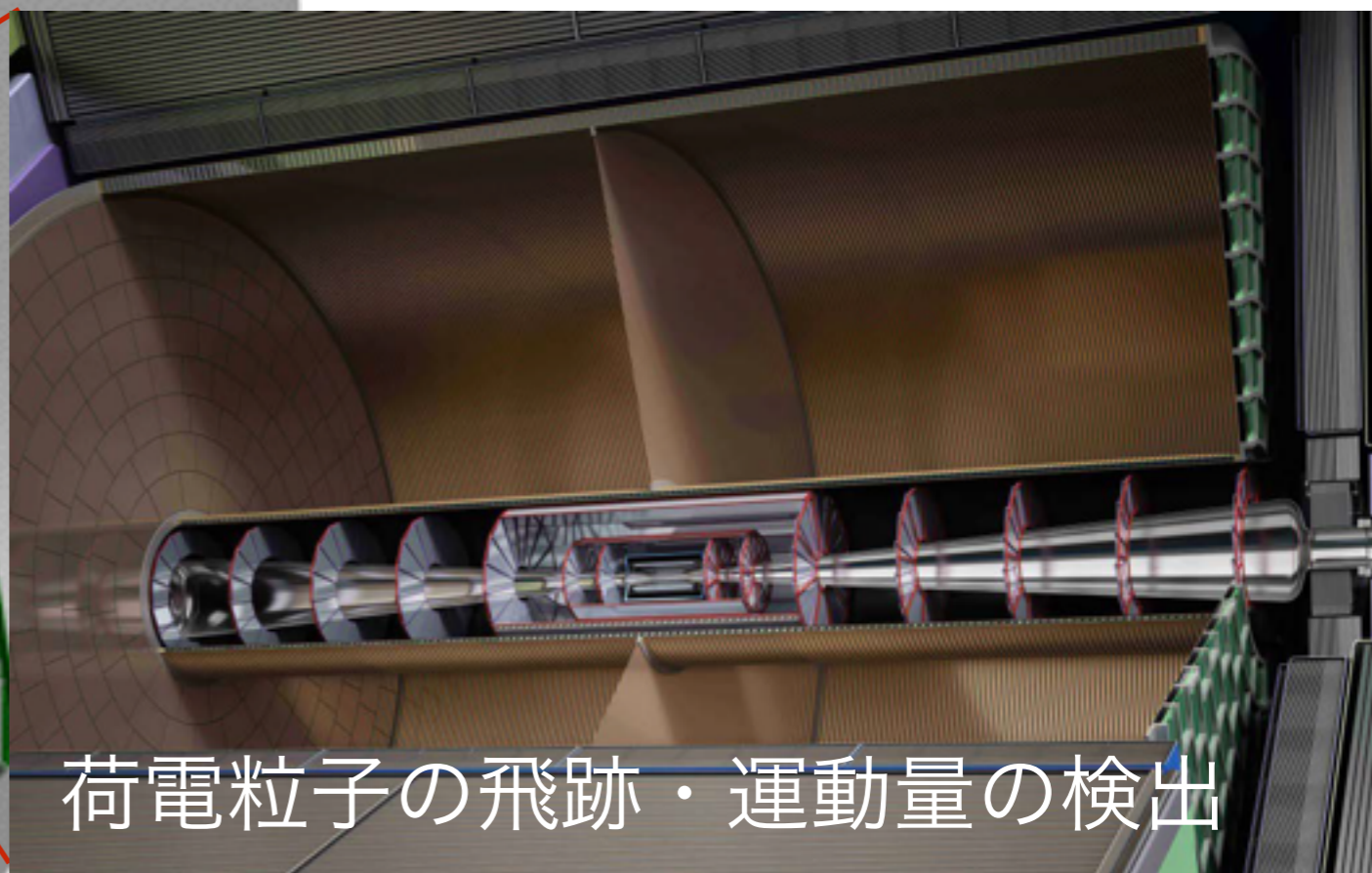
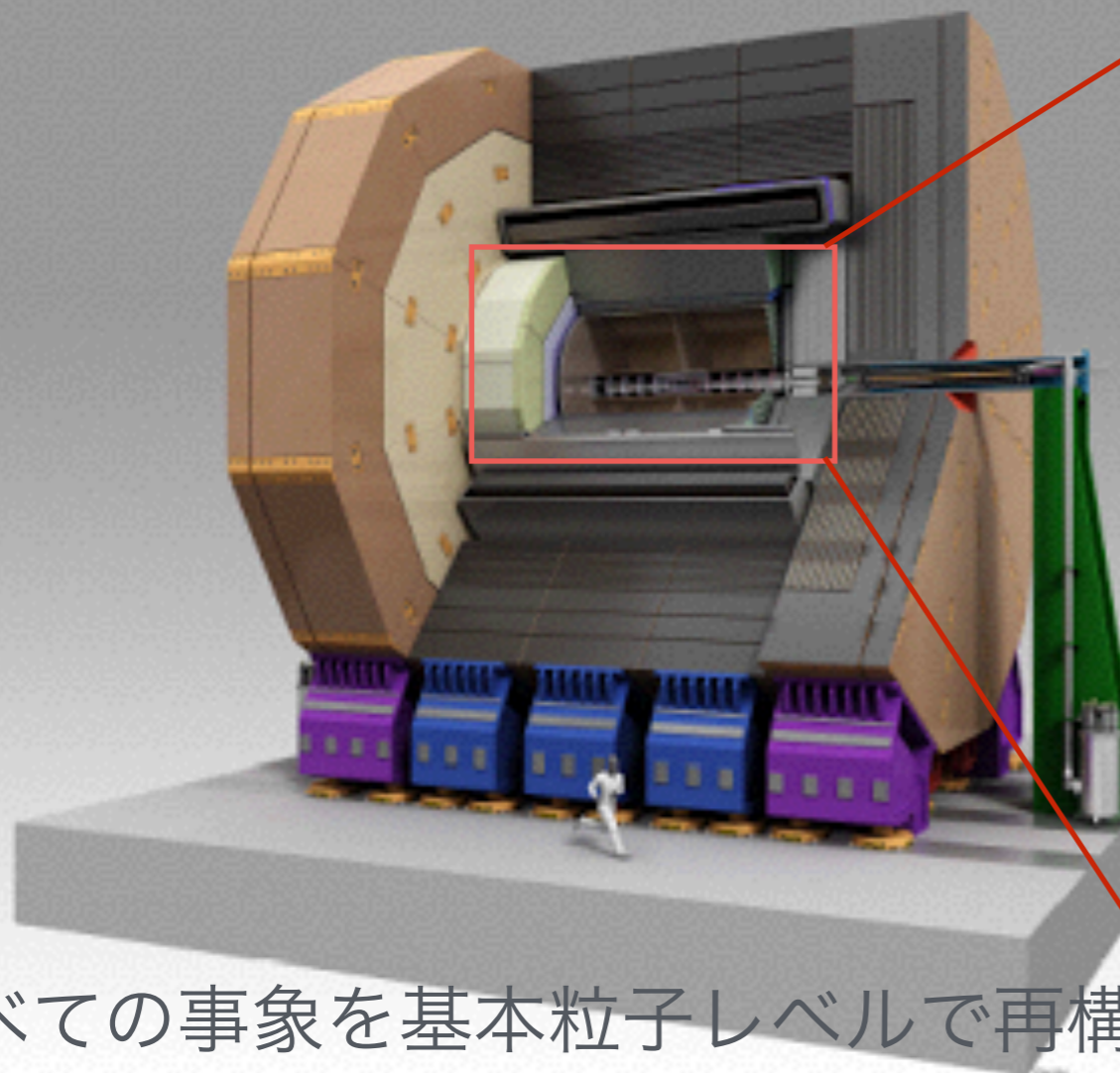


ILD

ILC-TPC用高開口度GEM型ゲート装置を 搭載したTPC読み出しモジュールのビーム試験

International Large Detector
(国際) (大型) (測定器)

Time Projection Chamber
(時間) (投影型) (チャンバー)

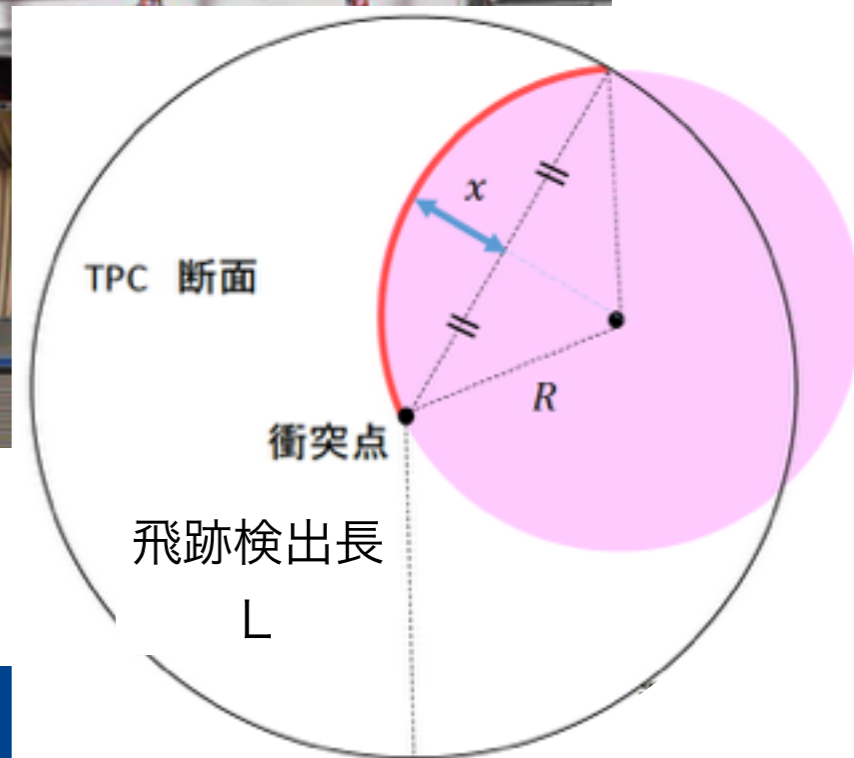
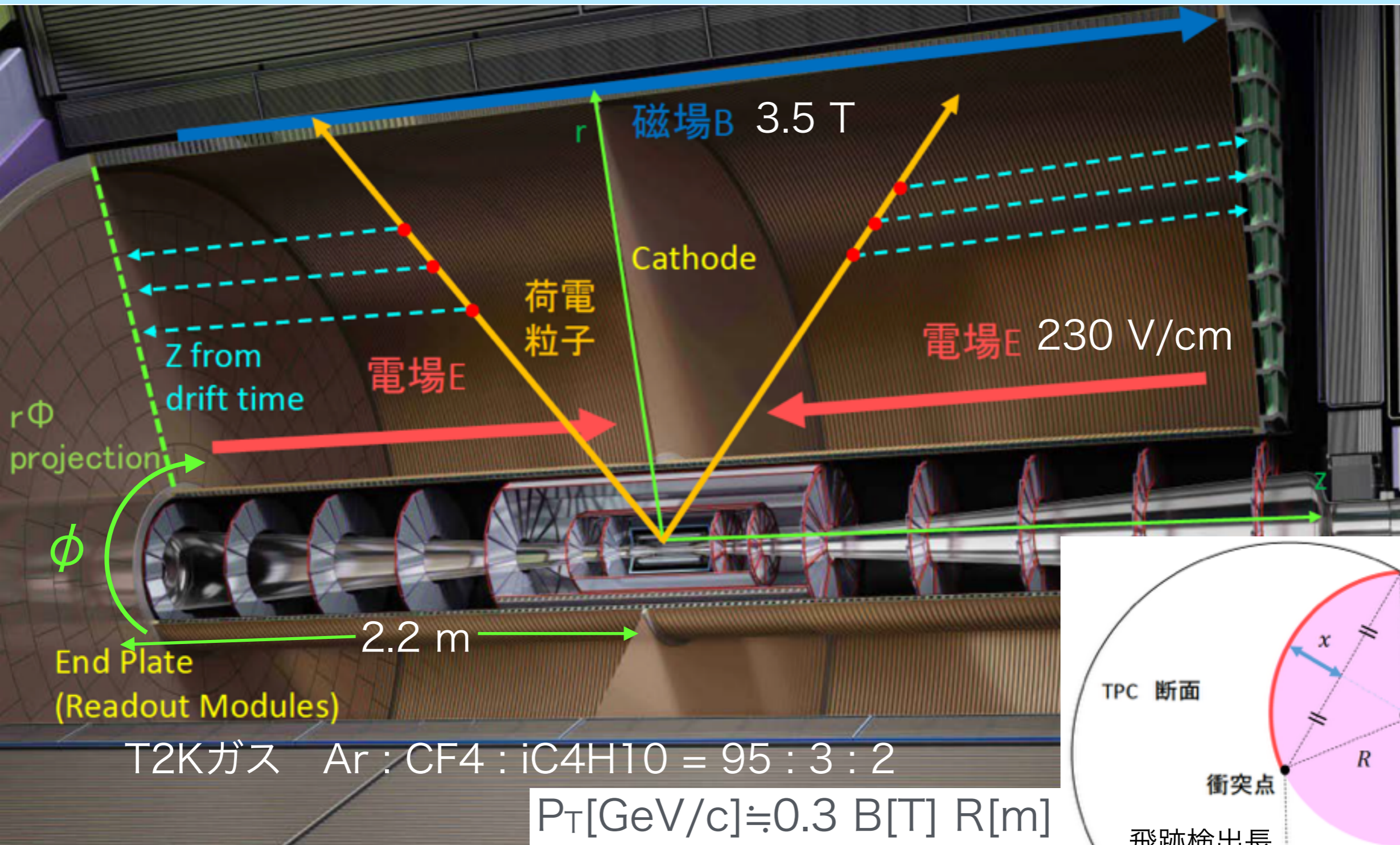


荷電粒子の飛跡・運動量の検出

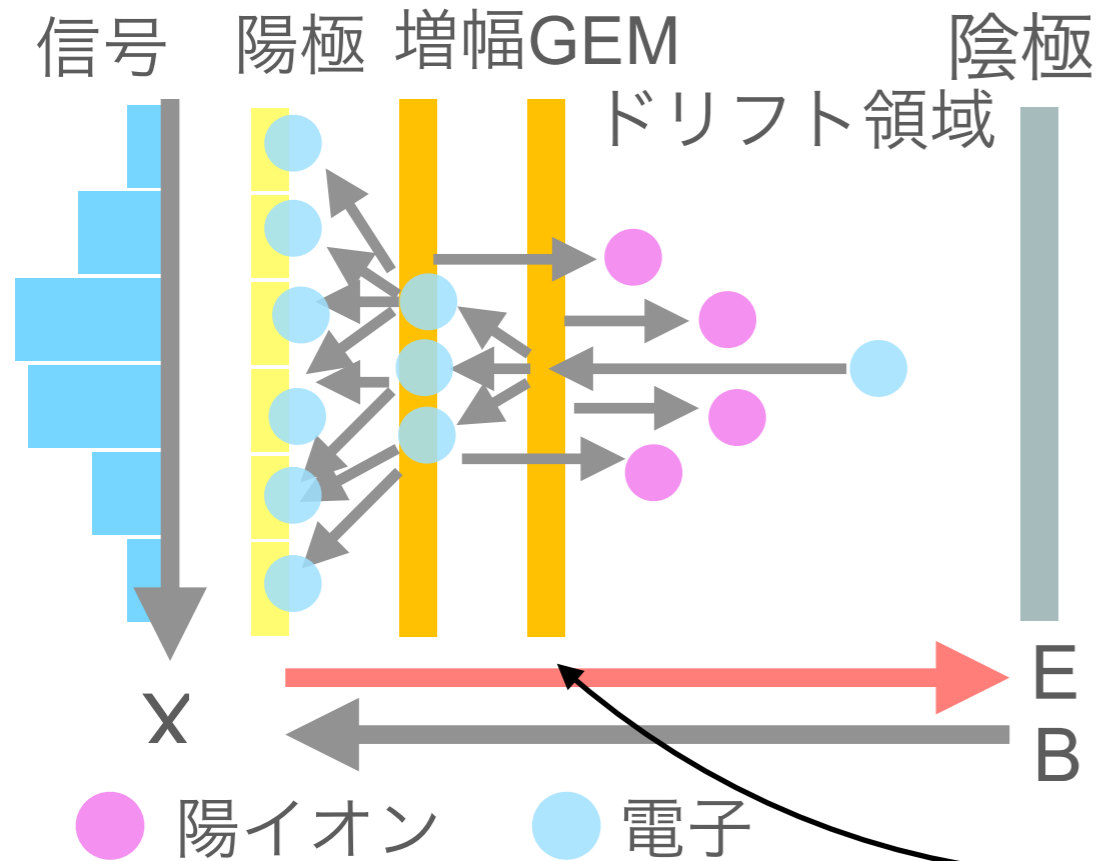
すべての事象を基本粒子レベルで再構成する

運動量分解能の目標 $\frac{\sigma_{P_T}}{P_T} \simeq 1 \times 10^{-4} P_T \text{ GeV}/c$

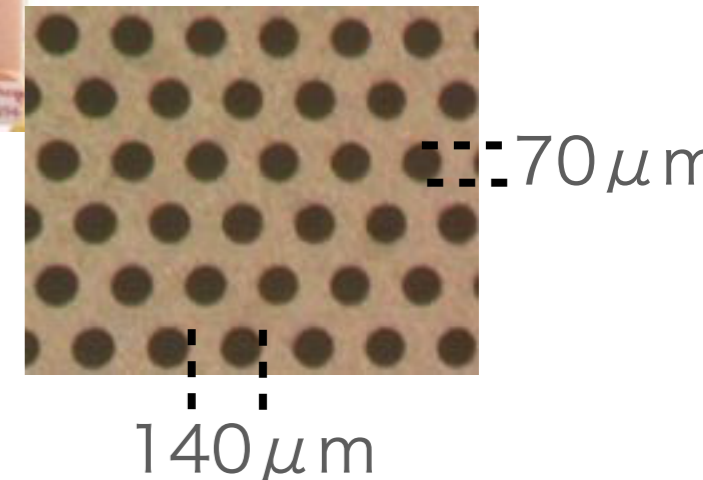
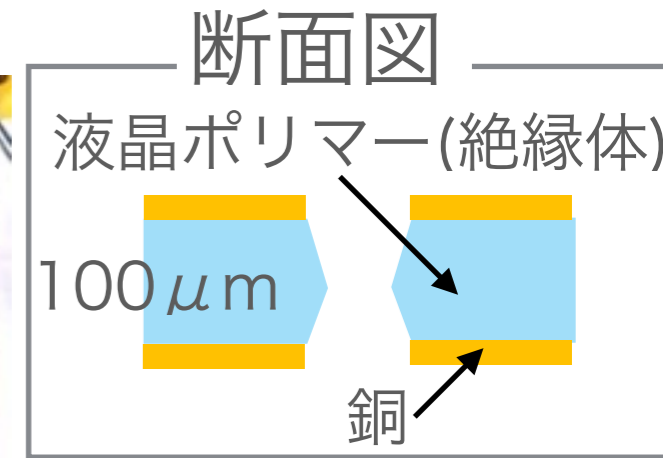
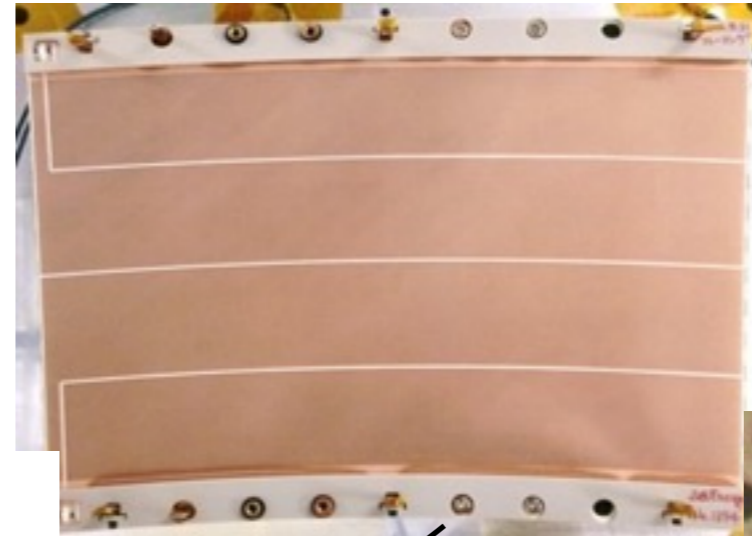
TPCの測定原理



TPCの検出原理と課題



Gas Electron Multiplier



穴の中で電子雪崩を起こし増幅

陽イオンフィードバック問題

増幅で発生した陽イオンがドリフト領域に逆流→電場を歪ませ位置分解能が悪化

必要な位置分解能： $\sigma_{r\phi} < 100 \mu m$ (距離2.2m/磁場3.5T)

予想：60 μm以上

ドリフト領域に陽イオンが戻ってこないようにするゲートが必要

ILC-TPC用高開口度GEM型ゲート装置を 搭載したTPC読み出しモジュールのビーム試験

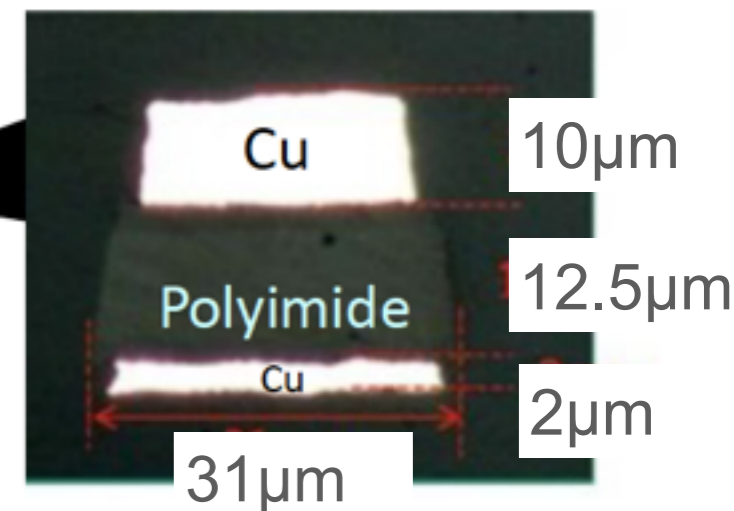
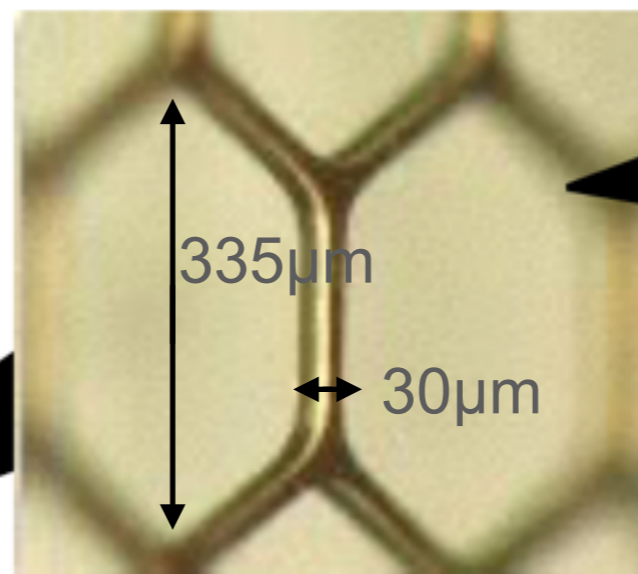
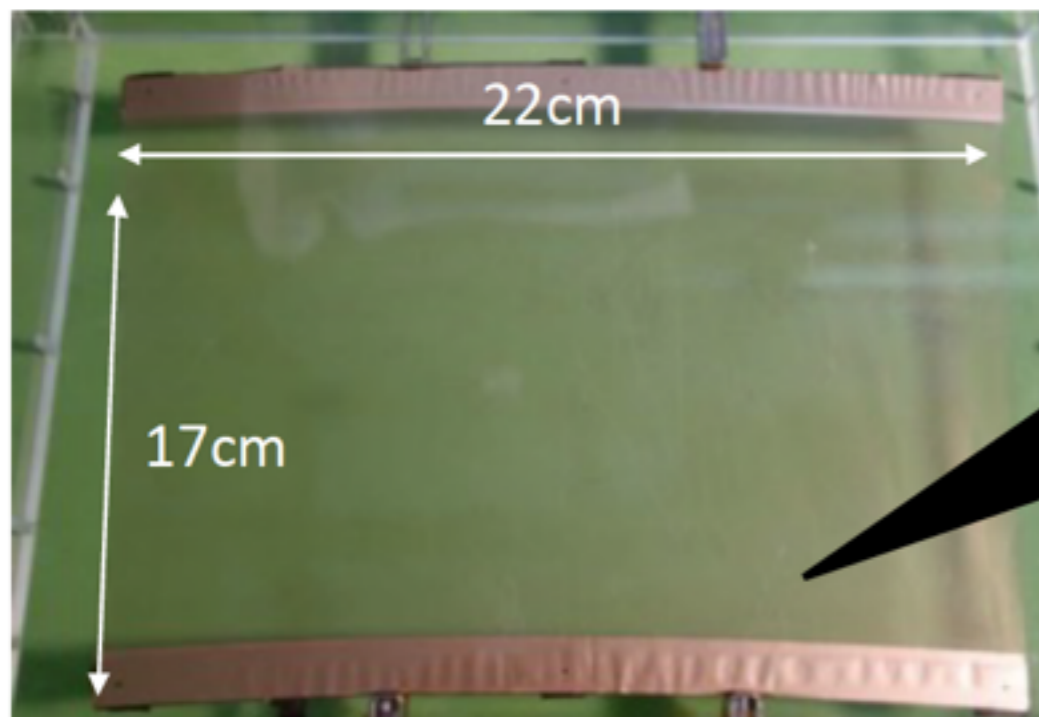
高開口度GEM型ゲート装置



GEMをゲートとして利用＝高開口度GEM型ゲート装置(ゲートGEM)

株式会社フジクラと共同開発

銅電極に電位差を与えることで動作



光学的開口度= 82 % 厚さ25 μm

ゲートは陽イオンを阻止する一方電子が通るのを邪魔してはいけない
→電子透過率も重要 達成可能な高磁場中での電子透過率≒光学的開口度

位置分解能100μmを達成するためには
電子透過率80%が必要

→ 今回ビームテストで確認

ILC-TPC用高開口度GEM型ゲート装置を 搭載したTPC読み出しモジュールのビーム試験

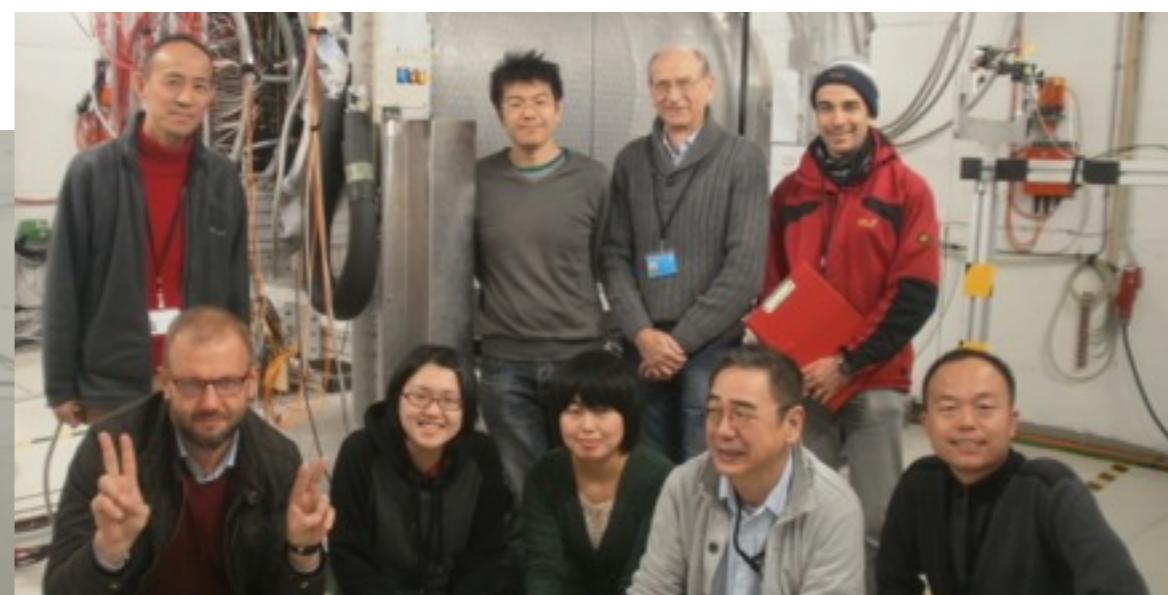
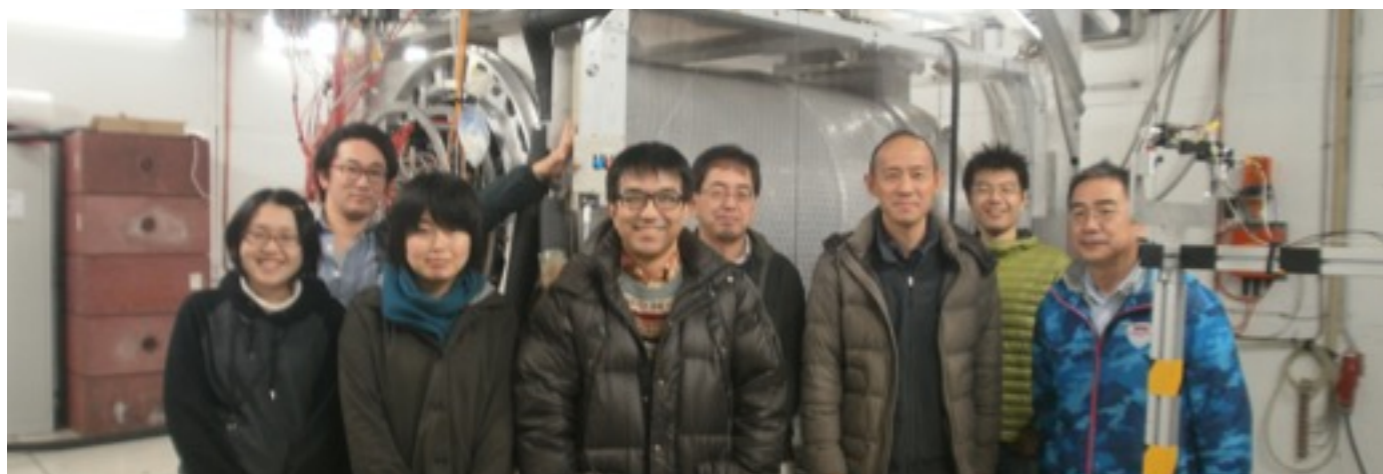
ビーム試験



2016.10.31~11.13 (ビームタイム)
@DESY TPC大型プロトタイプ

ゲートGEMを搭載したモジュールの
初めてのビーム試験

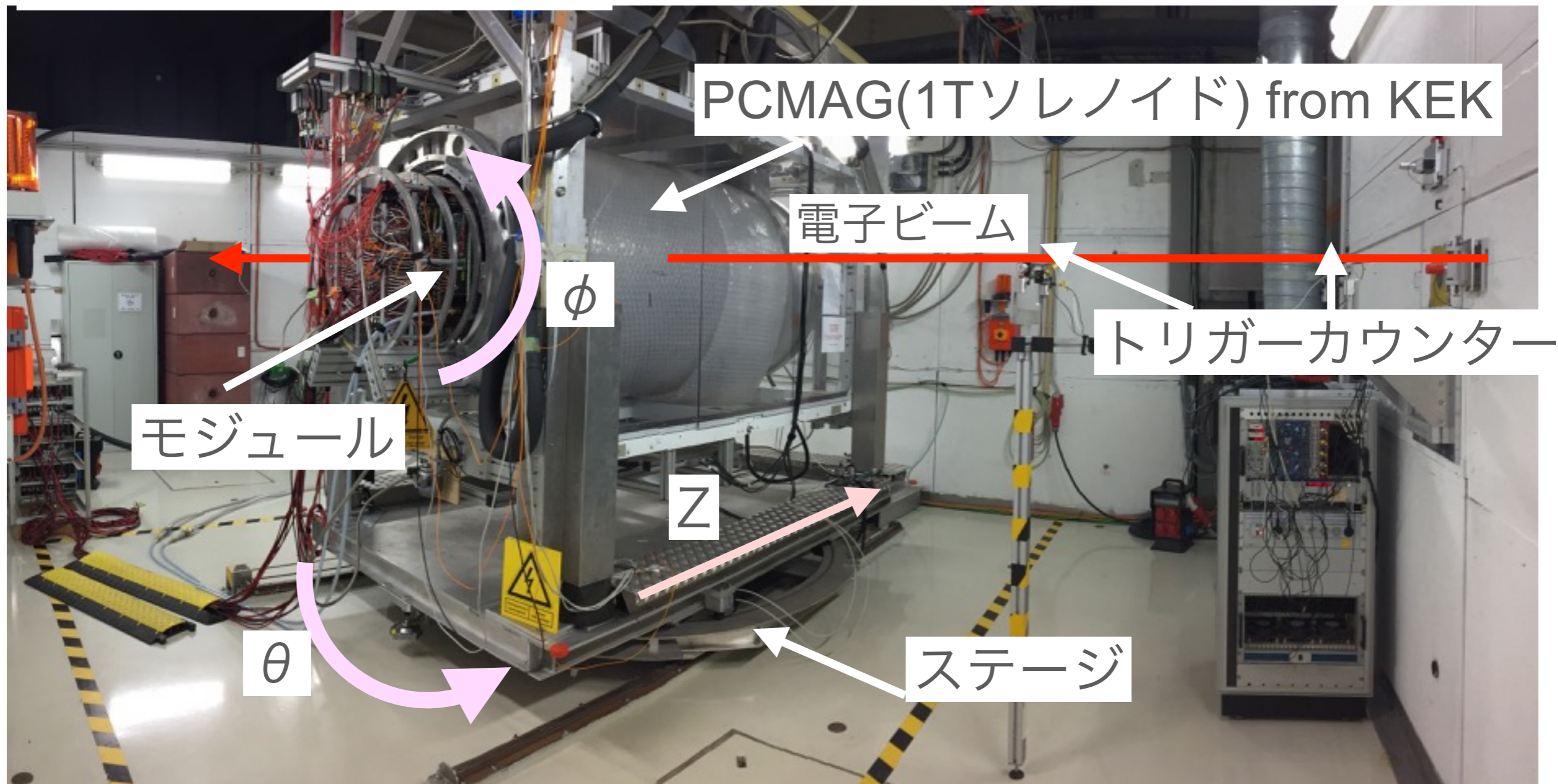
日本、フランス、ドイツ、中国から
15人が参加



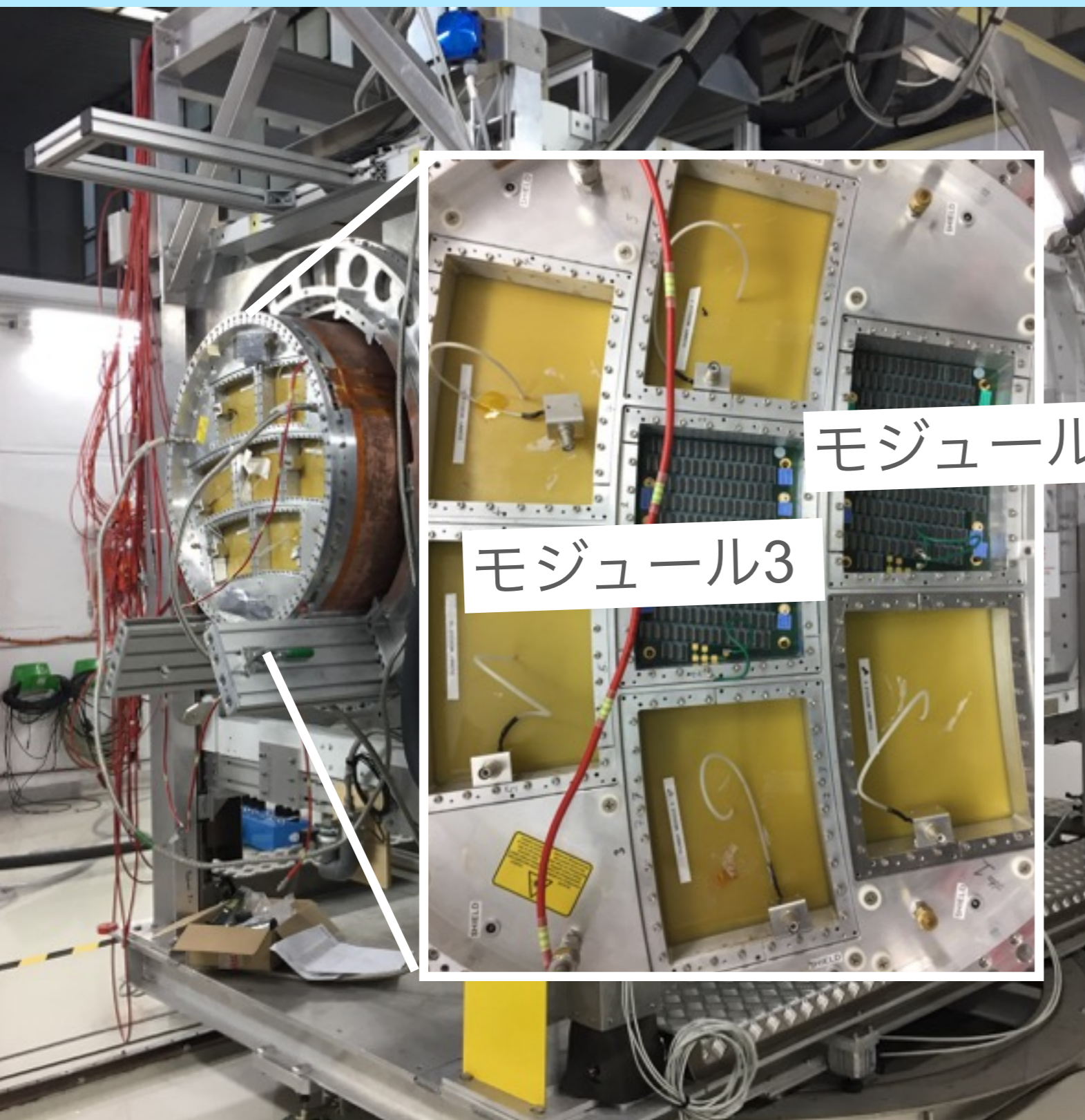
実験装置



TPCの大型プロトタイプ



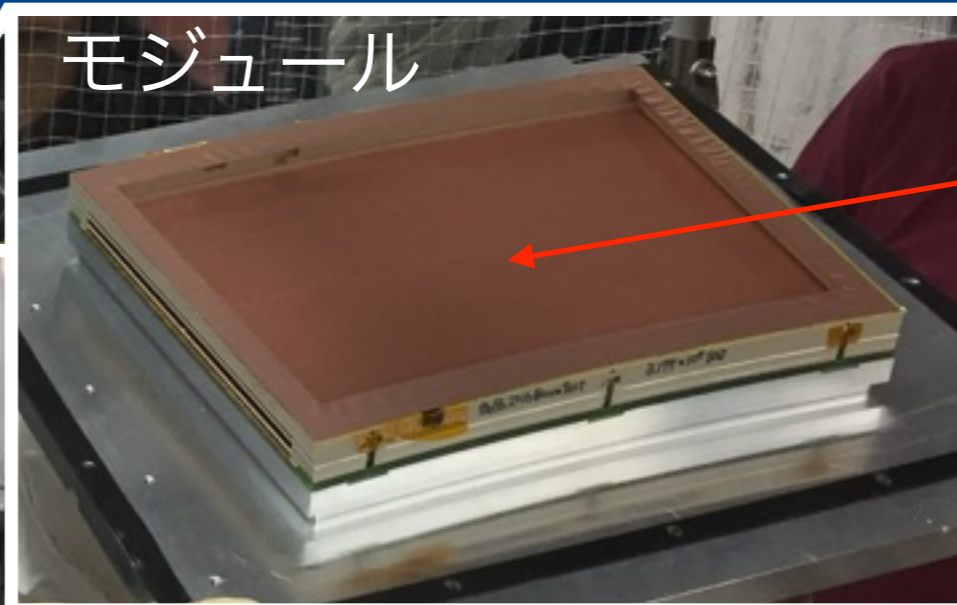
ゲートGEMを搭載したモジュール



モジュール0

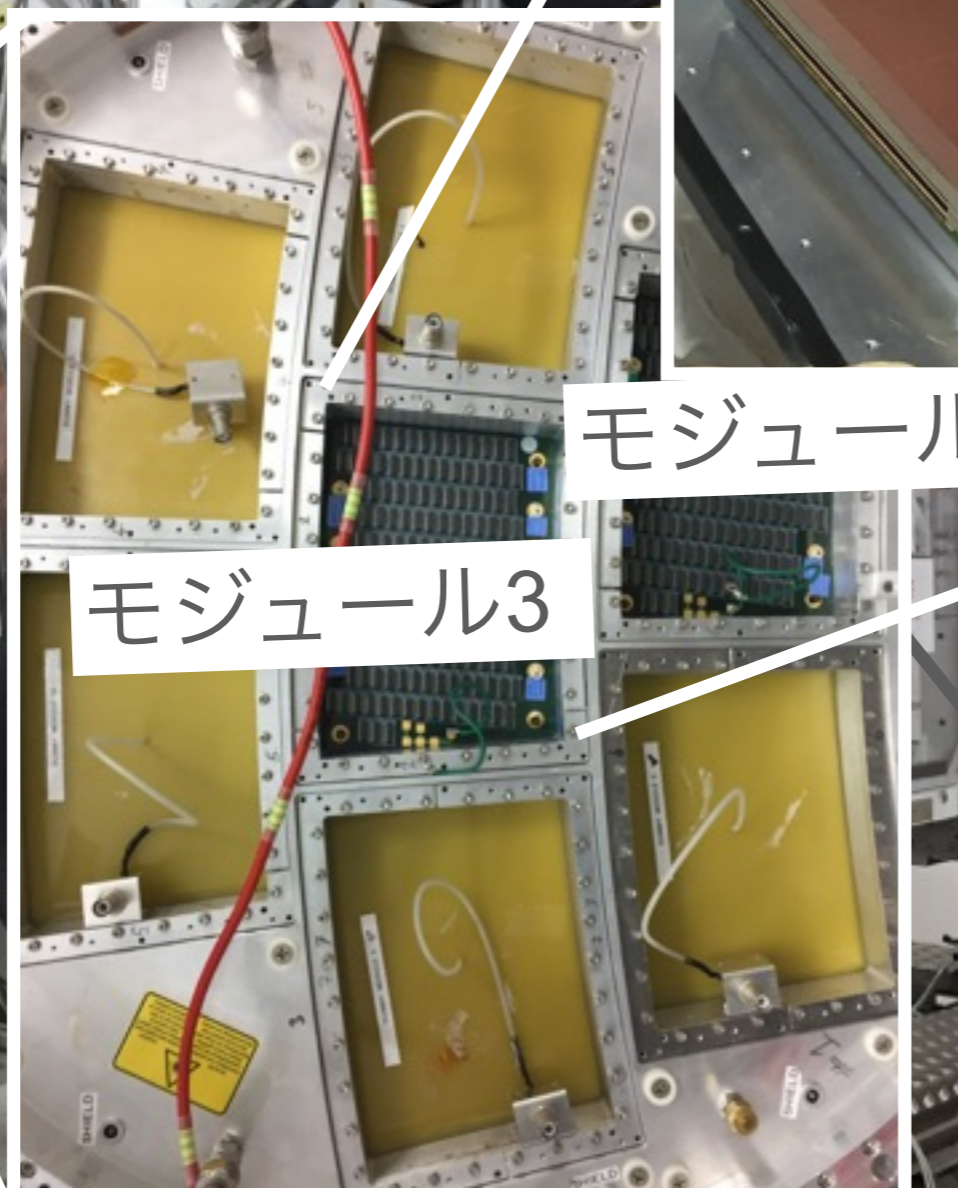
モジュール3

ゲートGEMを搭載したモジュール



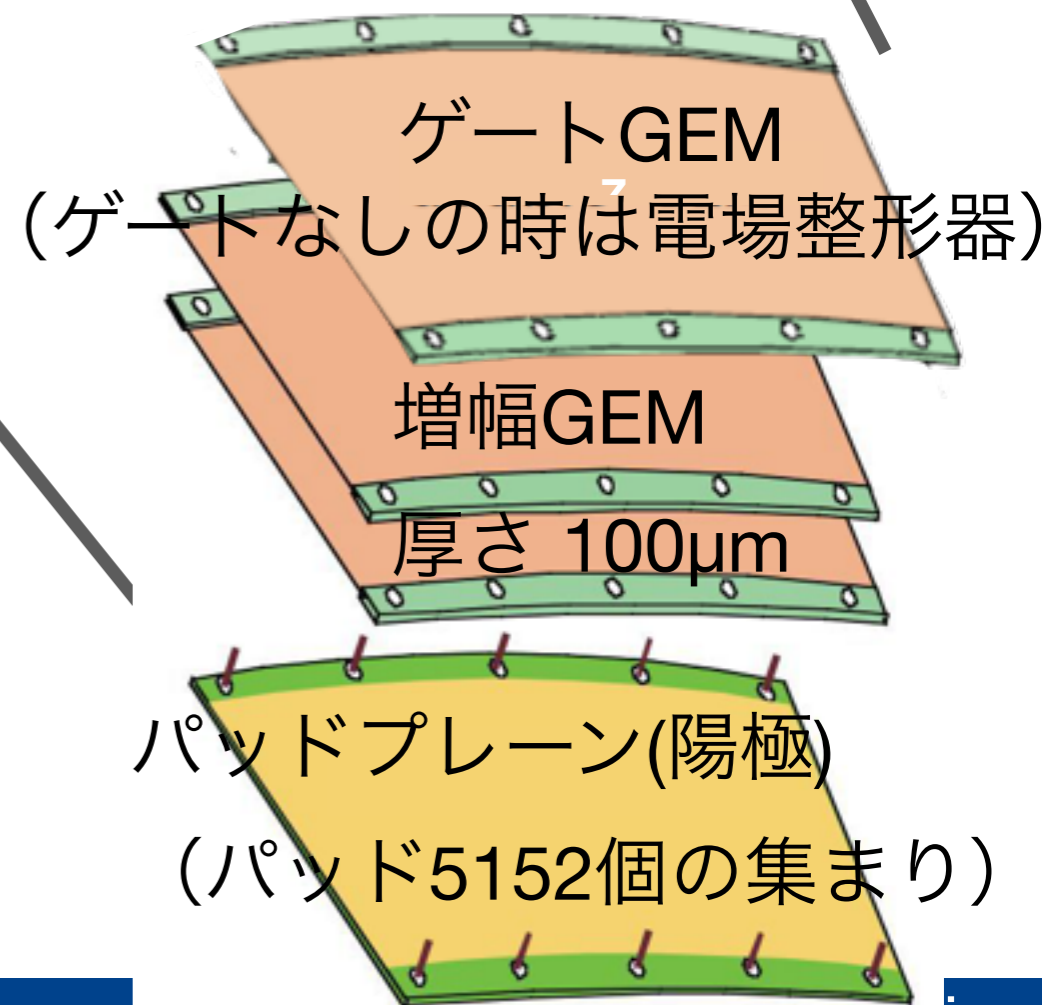
モジュール

ゲートGEM



モジュール0

モジュール3



実験条件



モジュール3	ゲートGEMあり	ゲートGEMなし
モジュール0	ゲートGEMなし	ゲートGEMなし

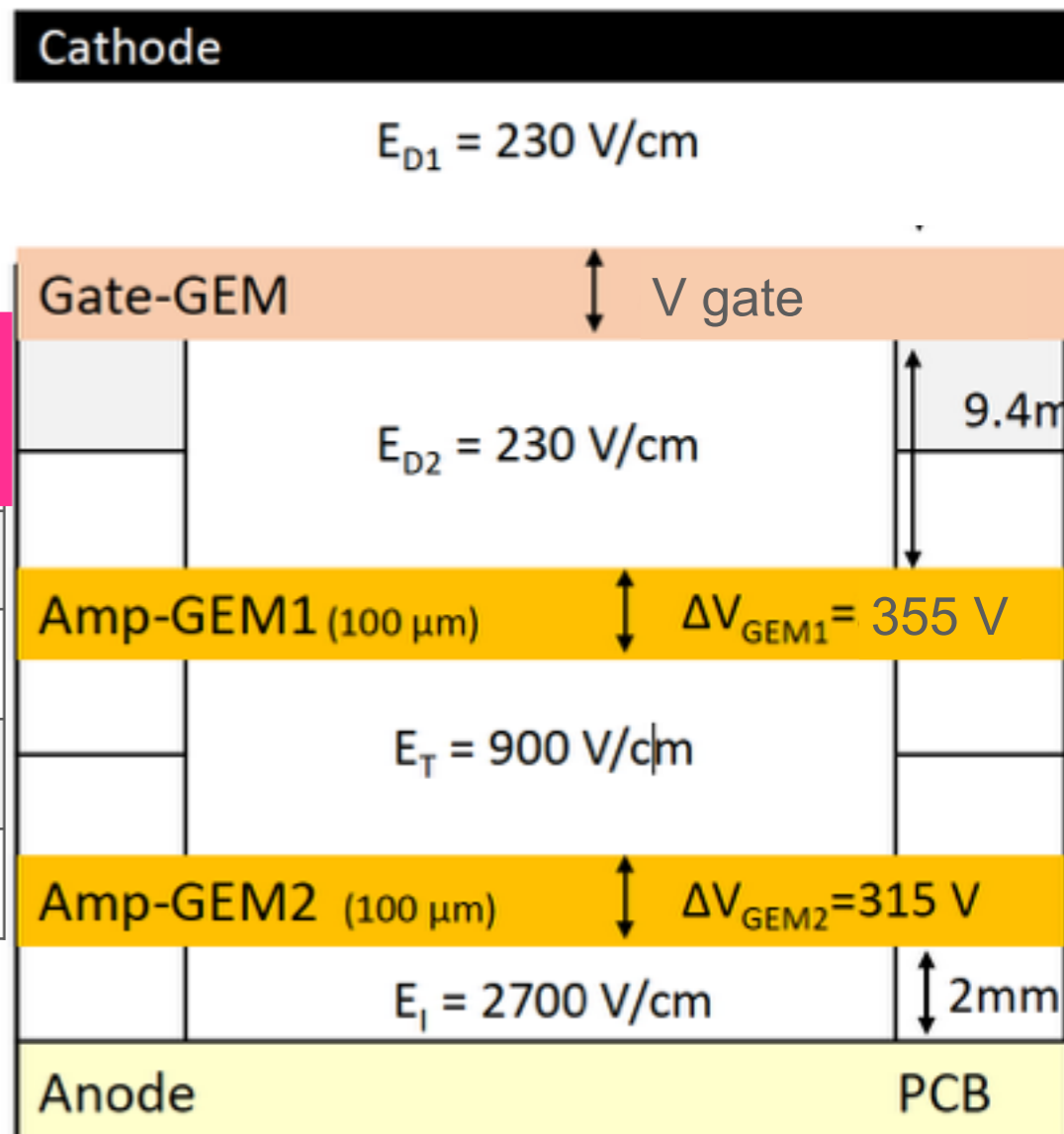
Z[cm] (ドリフト距離)	1.25, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
ϕ [degree]	0, 10, 20
θ [degree]	-20, -10, 0, 10, 20
V_{gate} [V]	-3.5, 0, 3.5
B [T]	0, 1

今回は 0, 10, 20 の条件の結果を解析

ビーム: 5 GeV 電子ビーム

ガス: T2K gas (Ar : CF₄ : Iso-C₄H₁₀ = 95 : 3 : 2 [%])

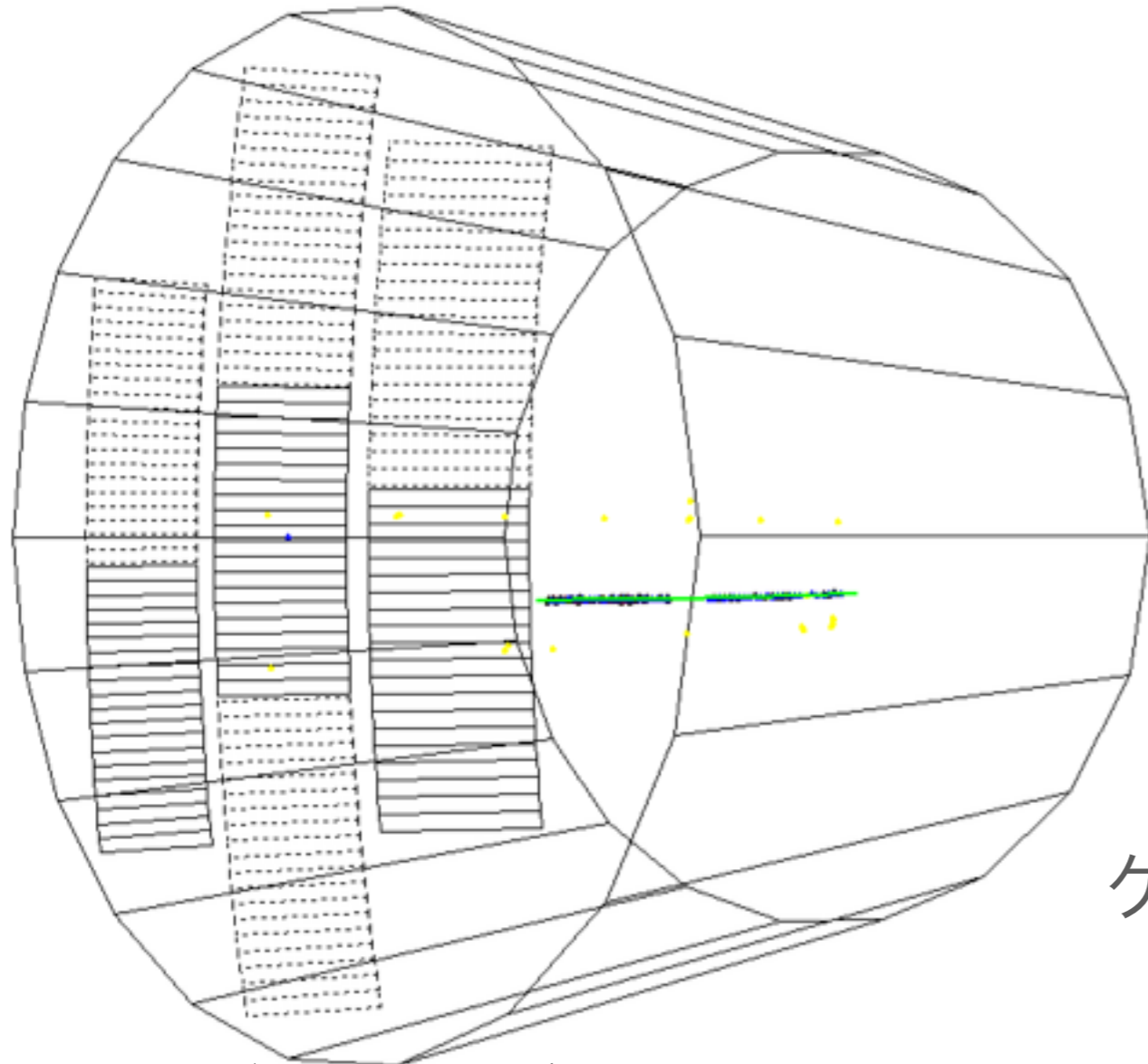
解析フレームワーク: MarlinTPC (20000イベント/1 runを解析)



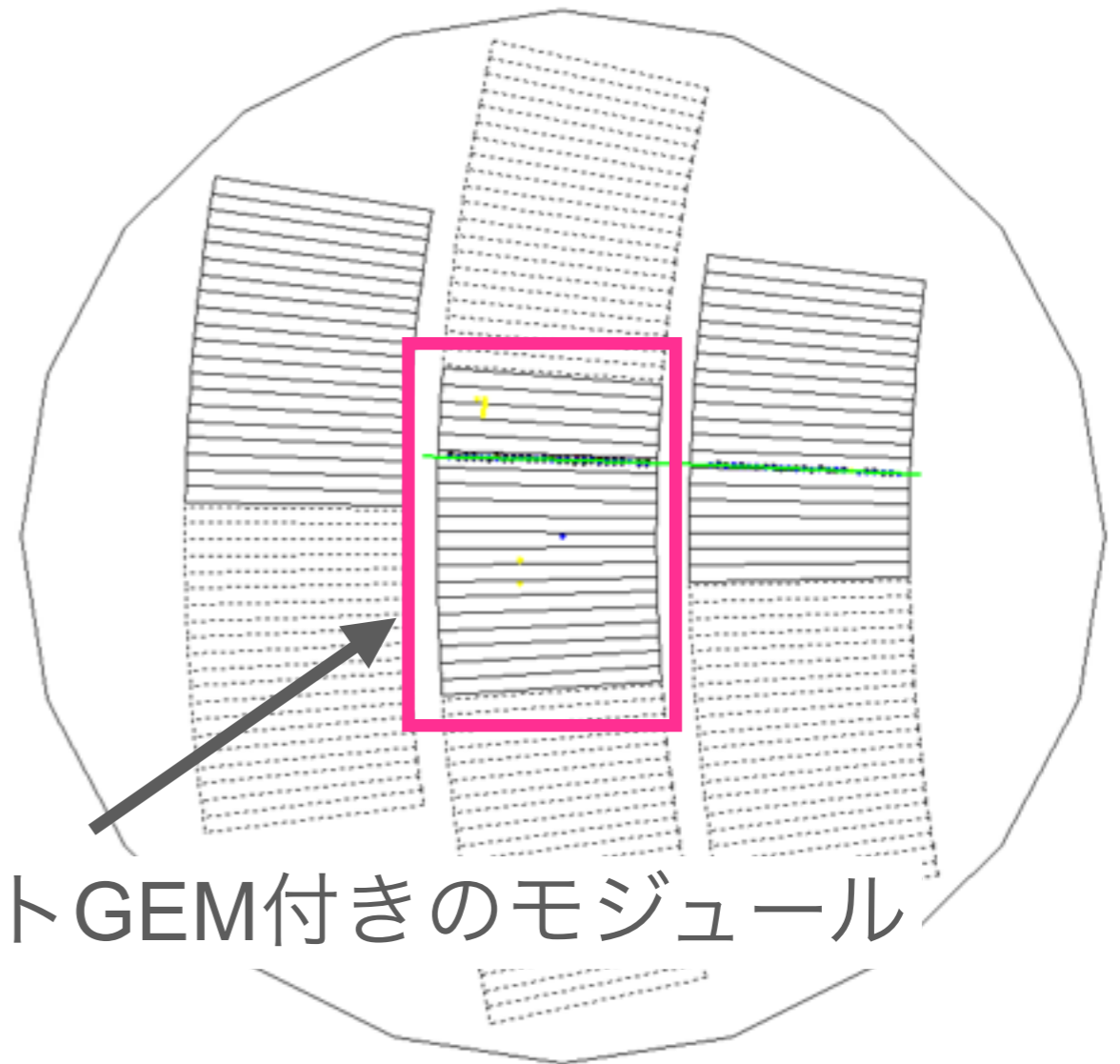
典型的なイベント



横からの図



正面からの図



ゲートGEM付きのモジュール

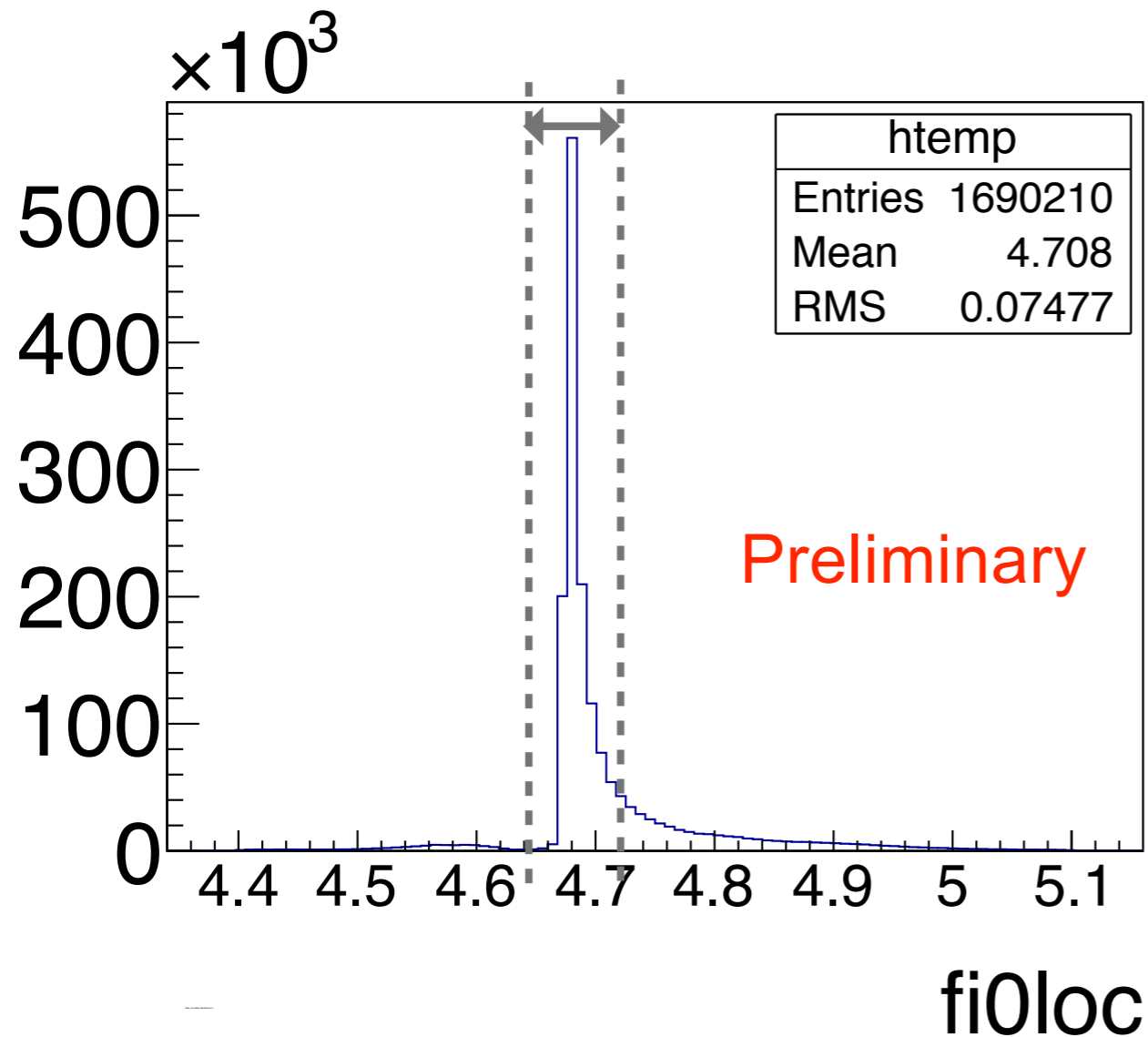
電子ビームはゲートGEM付きのモジュールの端から十分離れた部分
を通過している

飛跡選択



飛跡角度[rad]

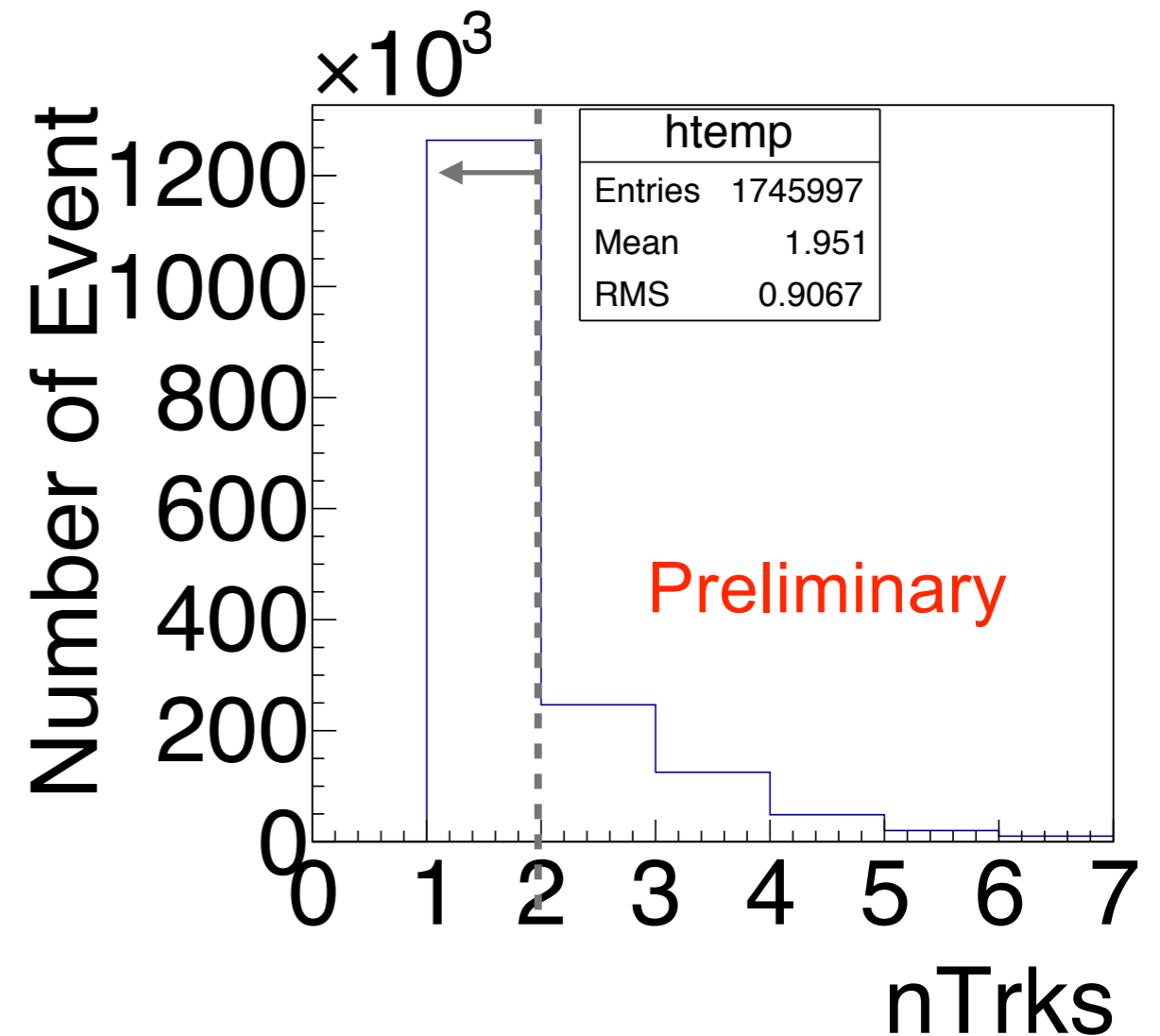
$$4.64 < \phi_0 < 4.72$$



垂直入射のトラックを選ぶ

1イベントの飛跡の数

$$nTrks = 1$$

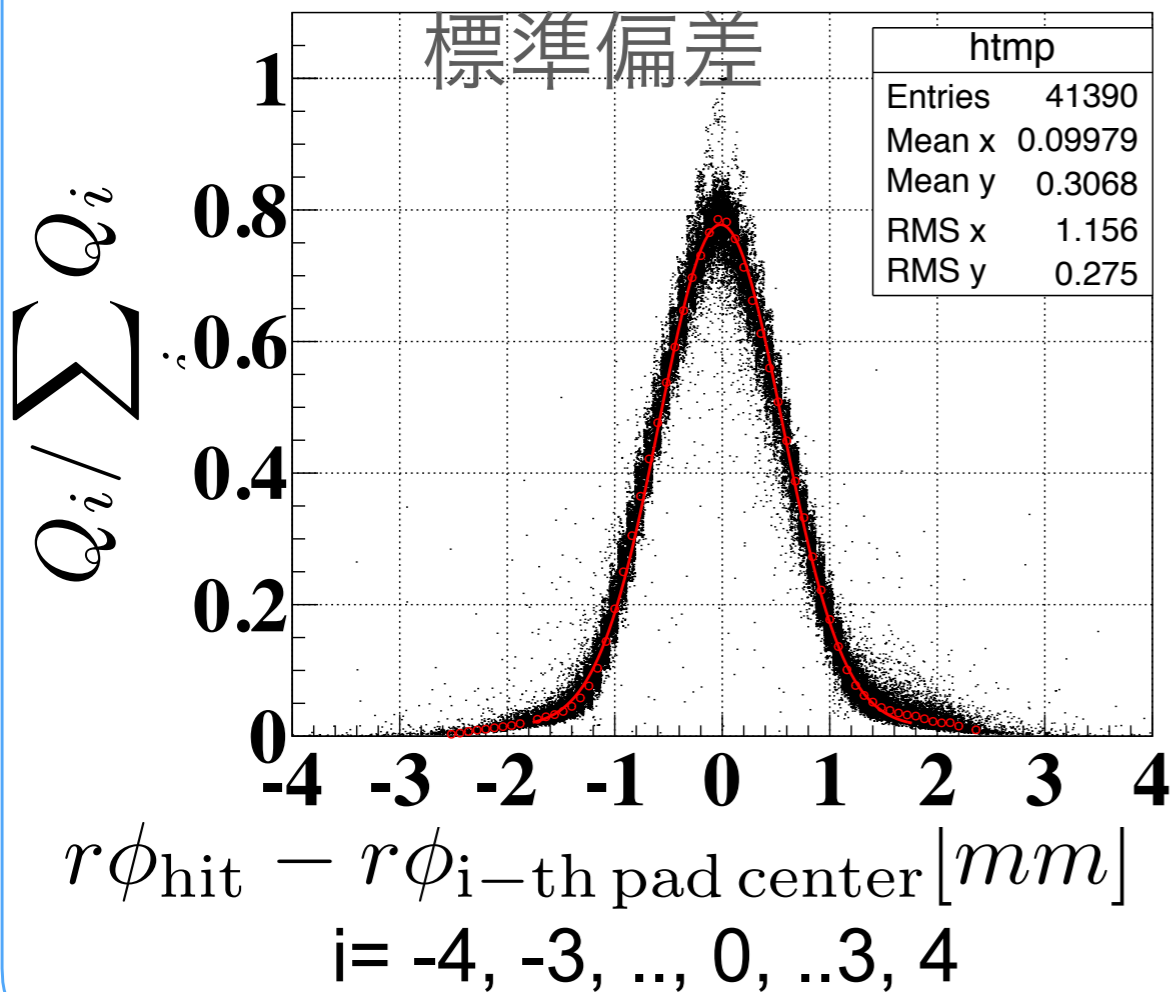


電磁シャワーになったものを除く

解析-電子透過率の求め方



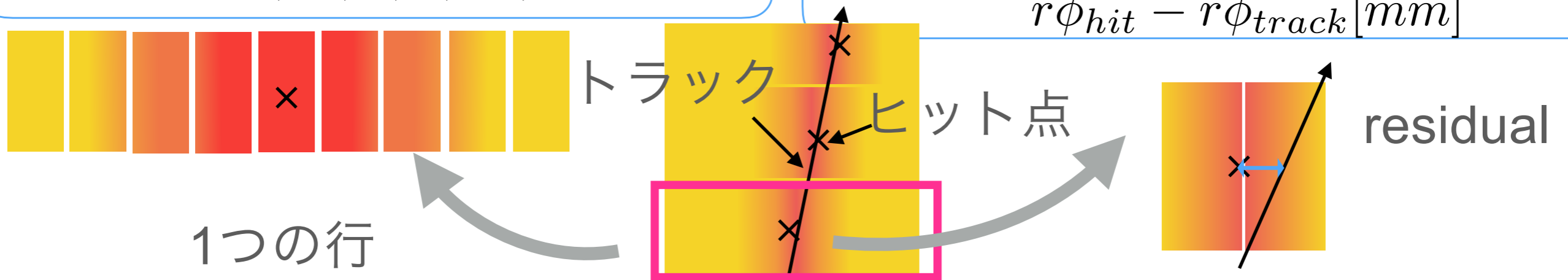
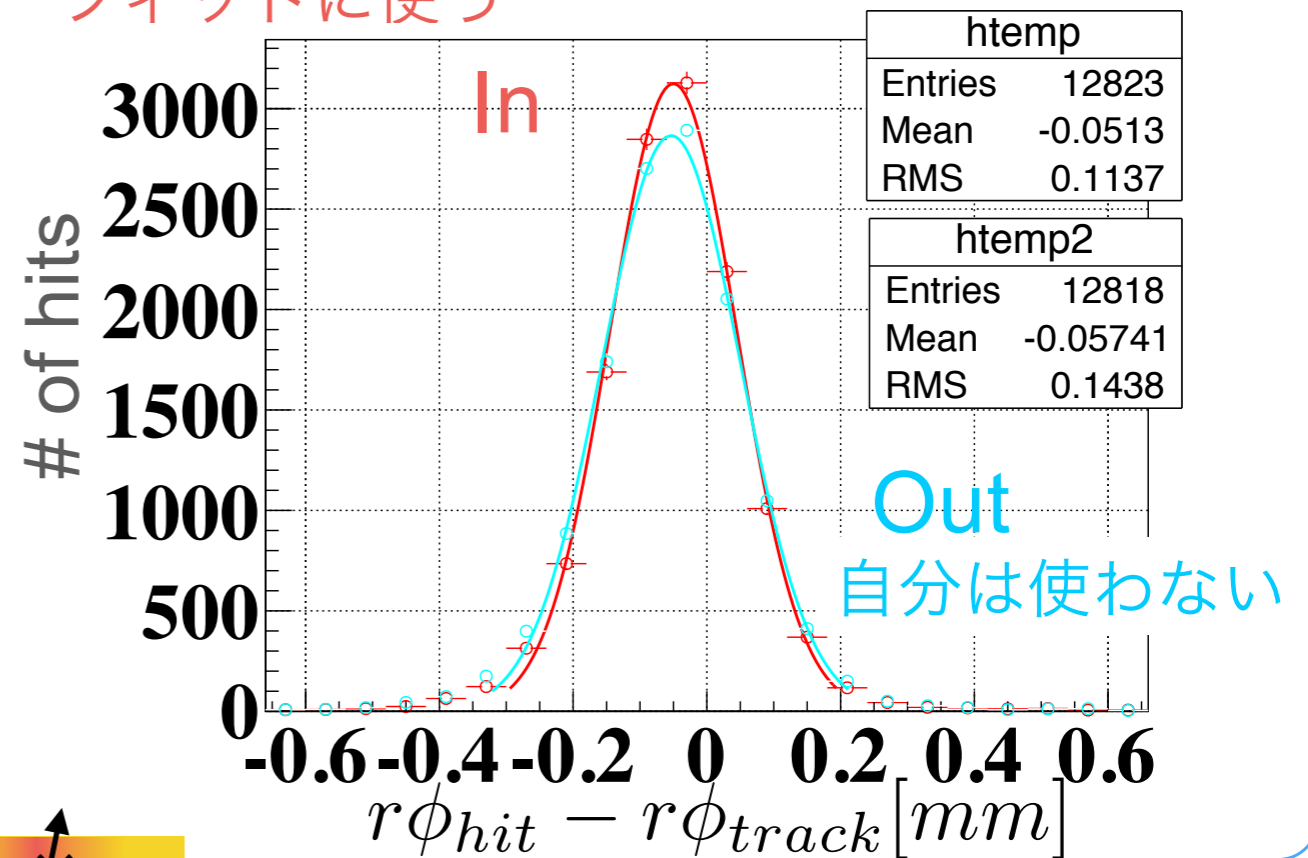
パッド応答関数 (σ_{PR})



位置分解能 ($\sigma_{r\phi}$)

$$\sigma_{r\phi} = \sqrt{\sigma_{r\phi(in)}\sigma_{r\phi(out)}}$$

自分もトラック
フィットに使う



解析-電子透過率の求め方



パッド応答関数 (σ_{PR})

距離 z を横軸にとりプロット

$$\sigma_{PR}^2 = \sigma_{PR}(0)^2 + (C_D^2)z$$

拡散定数

位置分解能 ($\sigma_{r\phi}$)

距離 z を横軸にとりプロット

$$\sigma_{r\phi} = \sqrt{\sigma_0^2 + \frac{(C_D^2)}{N_{eff}}z}$$

実効電子数 $N_{eff} = \left[\left\langle \frac{1}{N} \right\rangle \left\langle \left(\frac{G}{\bar{G}} \right)^2 \right\rangle \right]^{-1}$

実効電子数 N_{eff} を求める

N_{eff} の比 \equiv 電子透過率

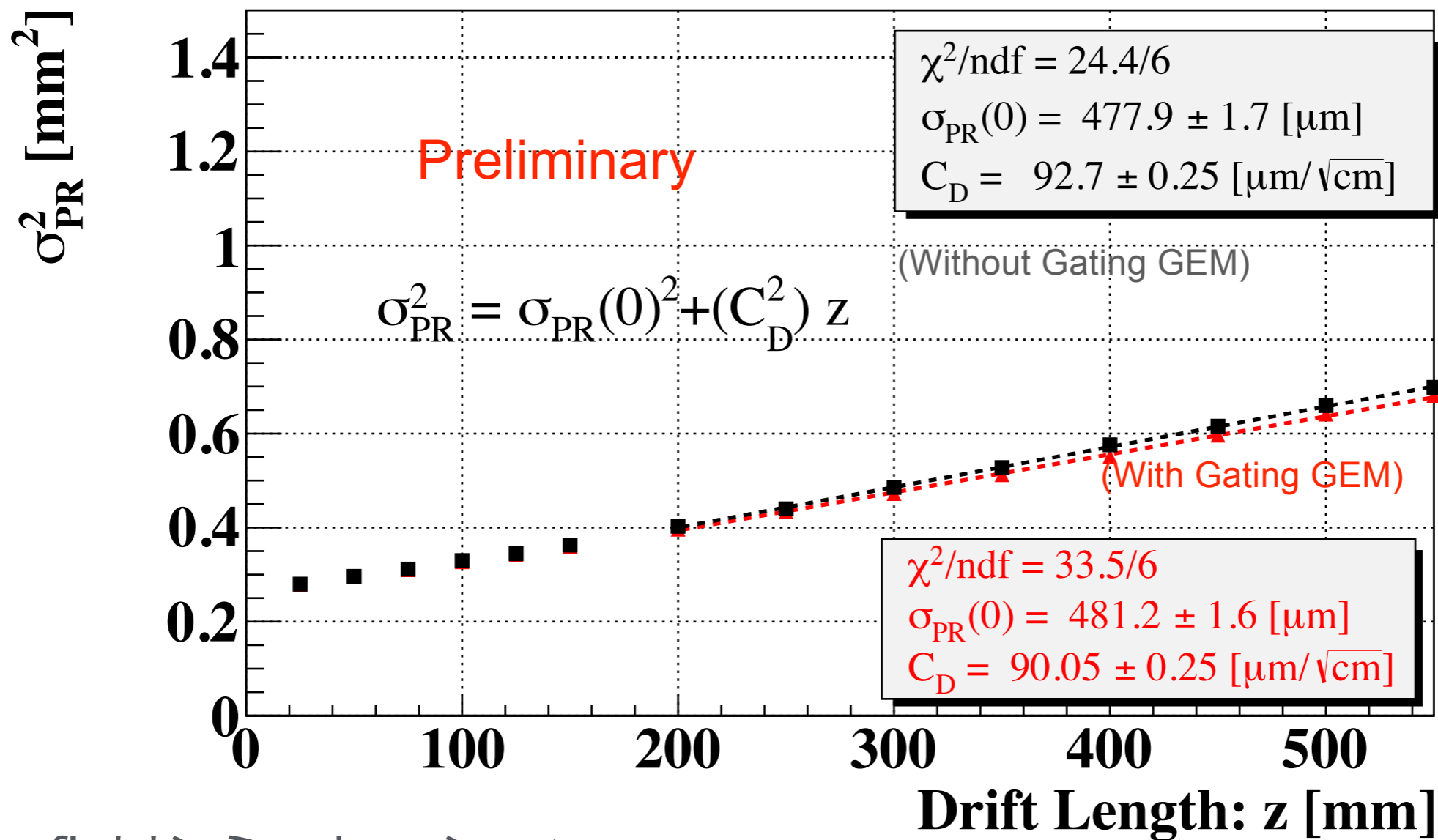
$$R_{e.t.} = \frac{\langle Q_{w/Gate} \rangle}{\langle Q_{w/o Gate} \rangle}$$

$$\frac{N_{eff}(w/Gate)}{N_{eff}(w/o Gate)} \approx R_{e.t.}$$

パッド応答関数



Pad Response (Module3 Row16)



Garfieldシミュレーション

ゲートありのときの温度圧力でのCd

94.1 $\mu\text{m}/\sqrt{\text{cm}}$ +/- 0.6%

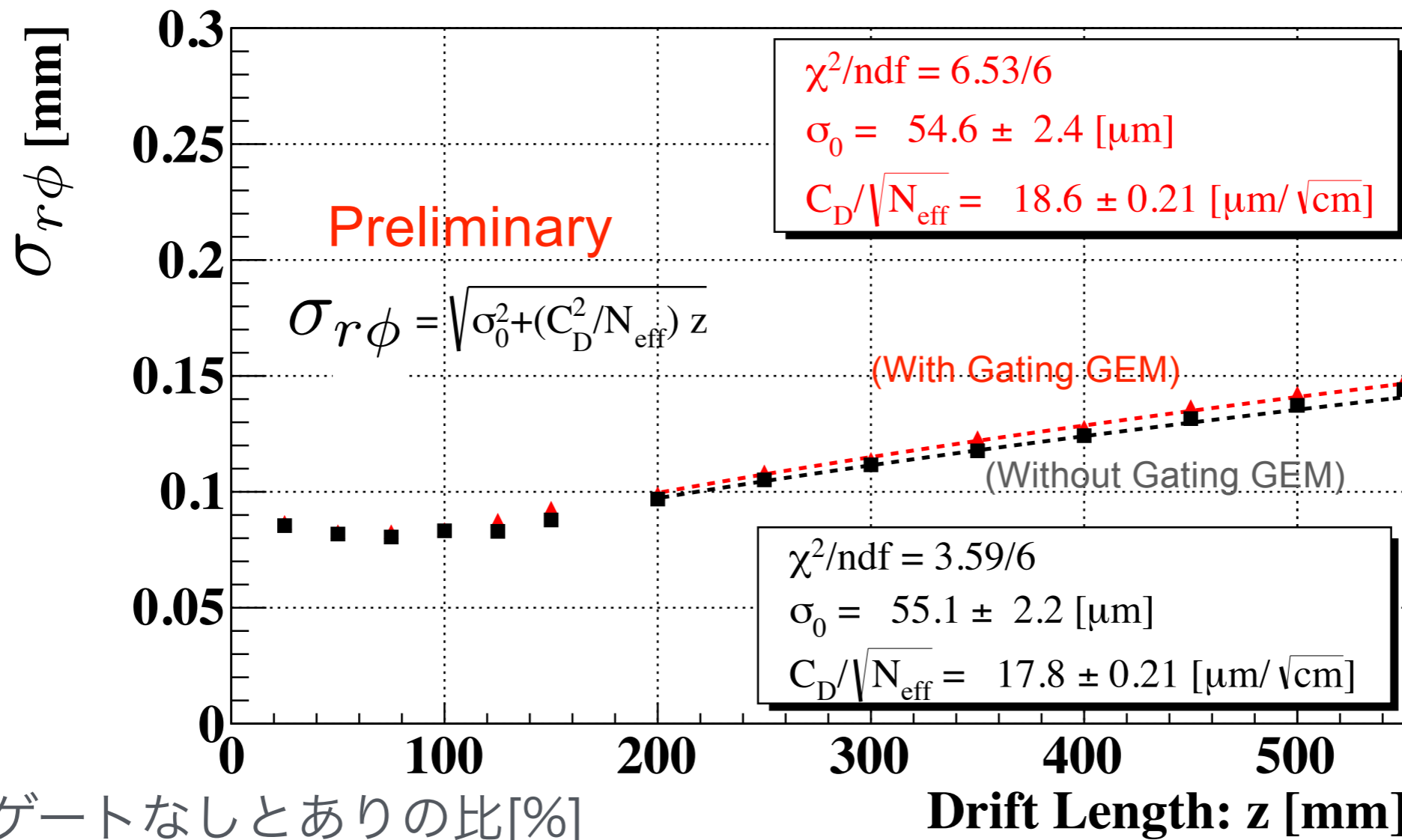
ゲートなしのときの温度圧力でのCd

94.3 $\mu\text{m}/\sqrt{\text{cm}}$ +/- 0.4%

位置分解能 (rφ)



GM Resolutin (Module3 Row16)



	2.5	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Ratio /%	101.7 ±0.1	101.2 ±0.1	102.9 ±0.1	100.7 ±0.1	105.8 ±0.1	105.8 ±0.1	102.4 ±0.1	103.3 ±0.1	102.1 ±0.1	104.8 ±0.1	103.0 ±0.1	104.0 ±0.1	103.8 ±0.1	102.7 ±0.2

予想されていた比率：110 %

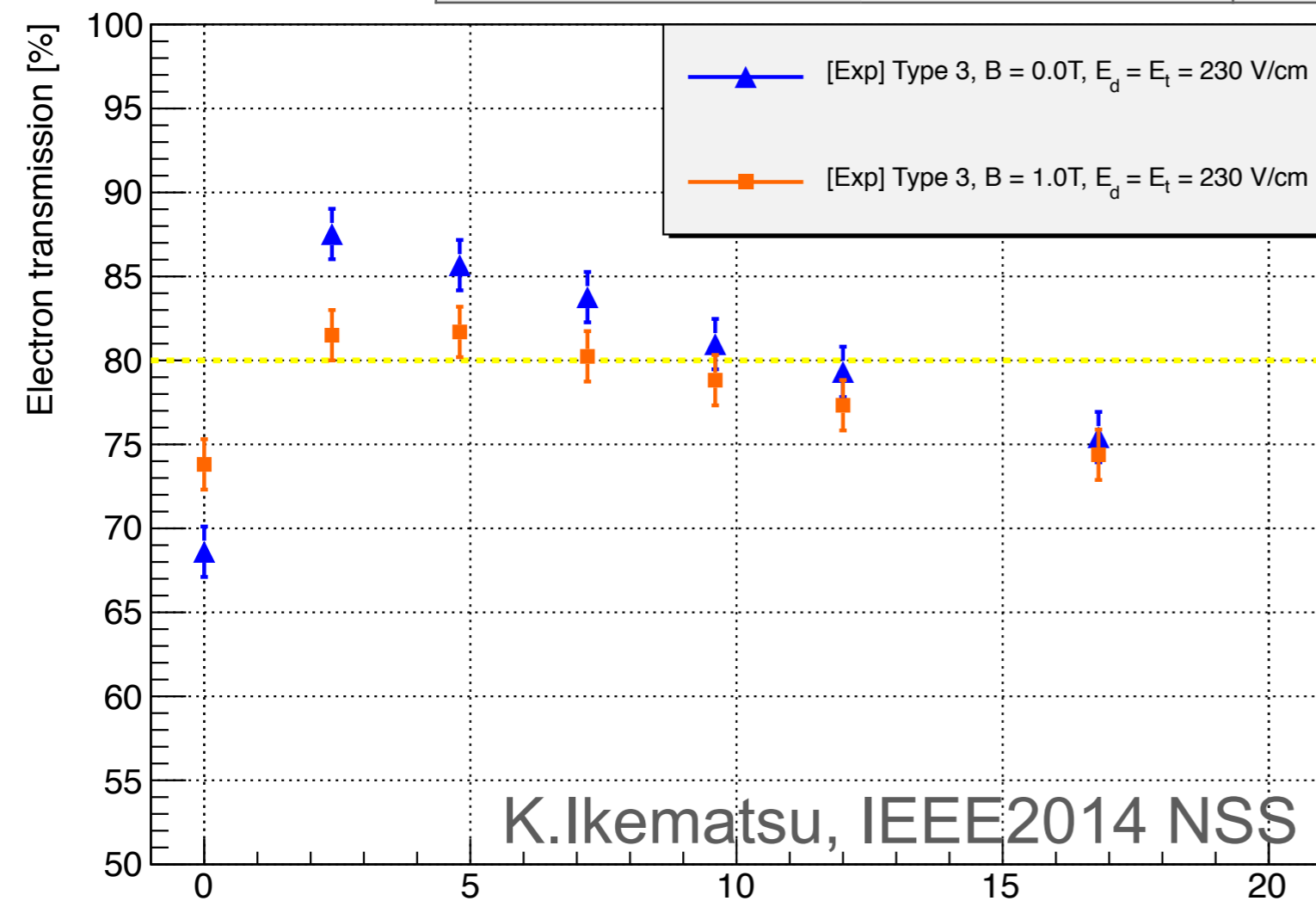
Preliminary(Stat. only)

yumia@post.kek.jp

電子透過率



使用したCd値 [$\mu\text{m}/\sqrt{\text{cm}}$]	ゲートありの N_{eff}	ゲートなし の N_{eff}	比率[%]
実測	23.4 ± 0.6	27.1 ± 0.7	86.4 ± 3.0
シミュレーション	26.7 ± 0.8	30.1 ± 0.8	88.8 ± 3.5



N_{eff} で評価した電子透過率は80%を達成している

小型プロトタイプの測定結果
≒ 82%により近いのは実測
Cd値を使ったとき

K.Ikematsu, IEEE2014 NSS

鉄55線源を使って測定した10cm×10cmプロトタイプの電子透過率 (1T)

高開口度GEM型ゲート装置を搭載したTPC読み出しモジュール
の初のビーム試験に成功した



実測したCd値を用いた電子透過率は $86.4 \pm 3.0\%$ であった

目標の電子透過率を達成している

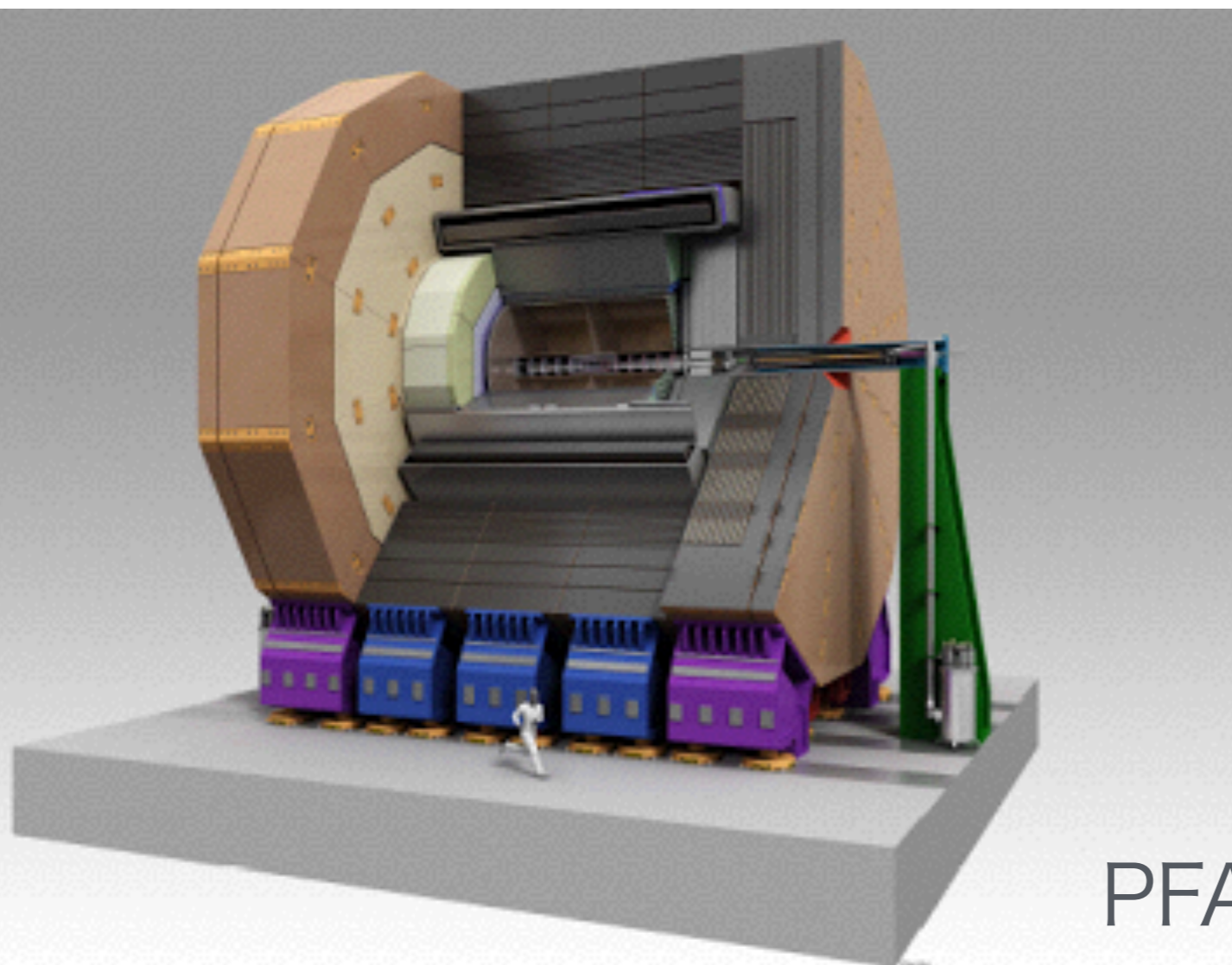
理解すべき課題点

ゲートあり/なしでCdに違いが見られたこと

同時に測っていたmodule0との比較などから今後
原因を追究する

補足スライド

International Large Detector (国際) (大型) (測定器)



荷電粒子は飛跡検出器で，光子
や中性ハドロン等の中性粒子は
カロリメータで重複なく測定す
ることにより，優れたジェット
PFA

エネルギー分解能を実現。

PFA: Particle Flow Analysis

それぞれの測定器の役割



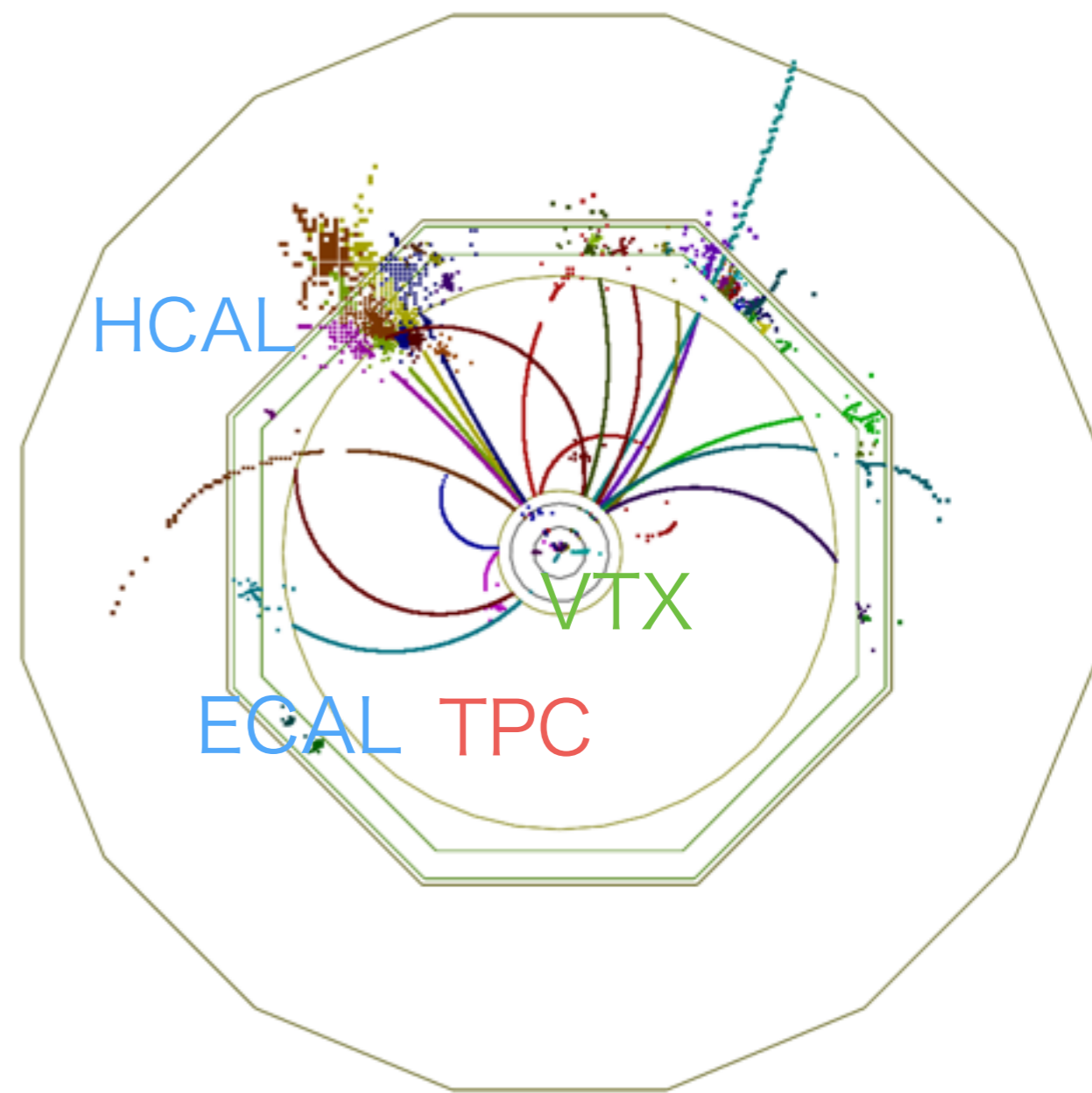
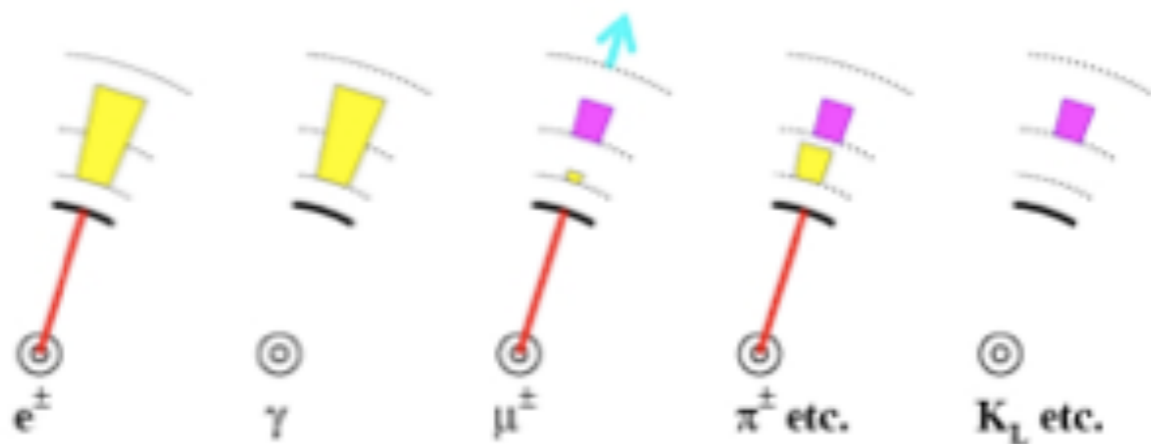
知りたいもの→すべての粒子の特定

2つの4元ベクトル

$$P^\mu = (E/c, \mathbf{p})$$

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x})$$

カロリメーター：中性粒子
飛跡検出器：荷電粒子



TPCの2つの役割



①荷電粒子の検出

飛跡検出 2次元

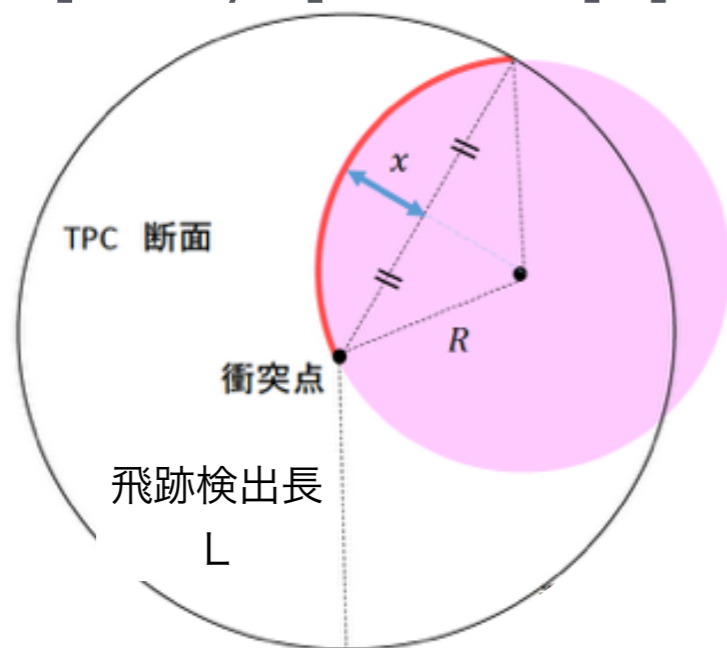
+

時間から求める残り1次元

運動量測定

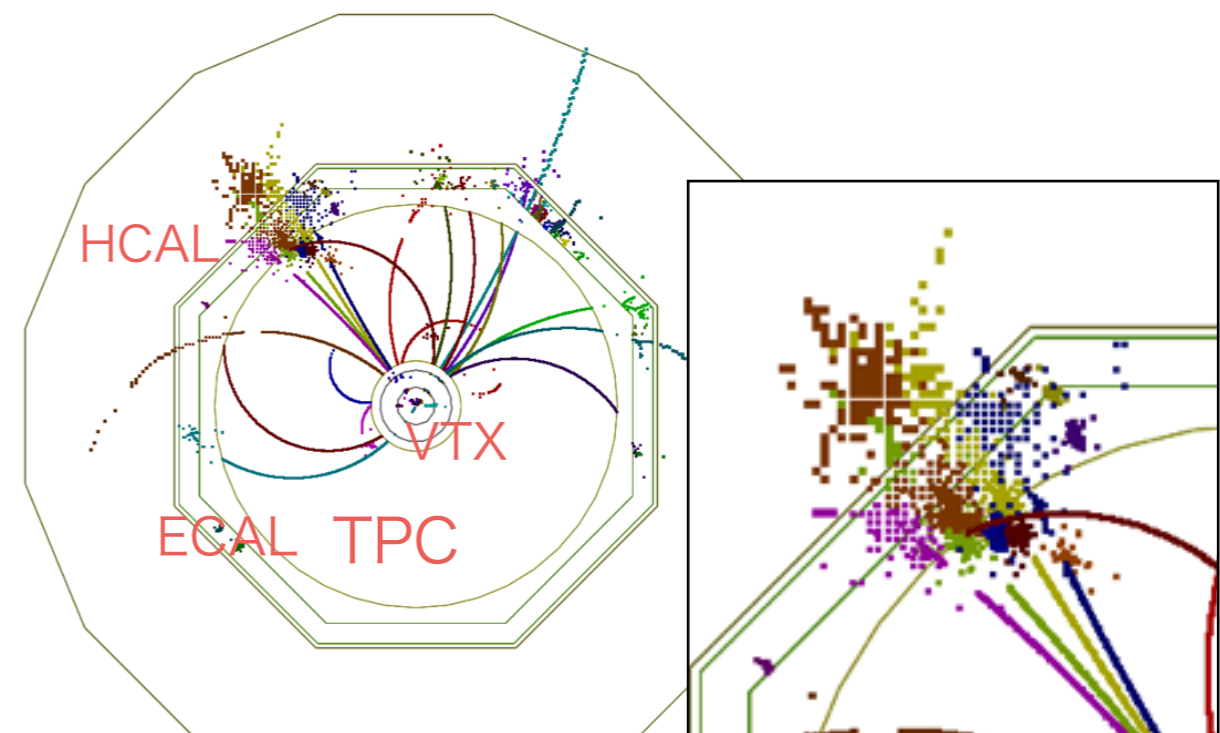
曲率半径・磁場から求める

$$P_T[\text{GeV}/c] \doteq 0.3 B[\text{T}] R[\text{m}]$$



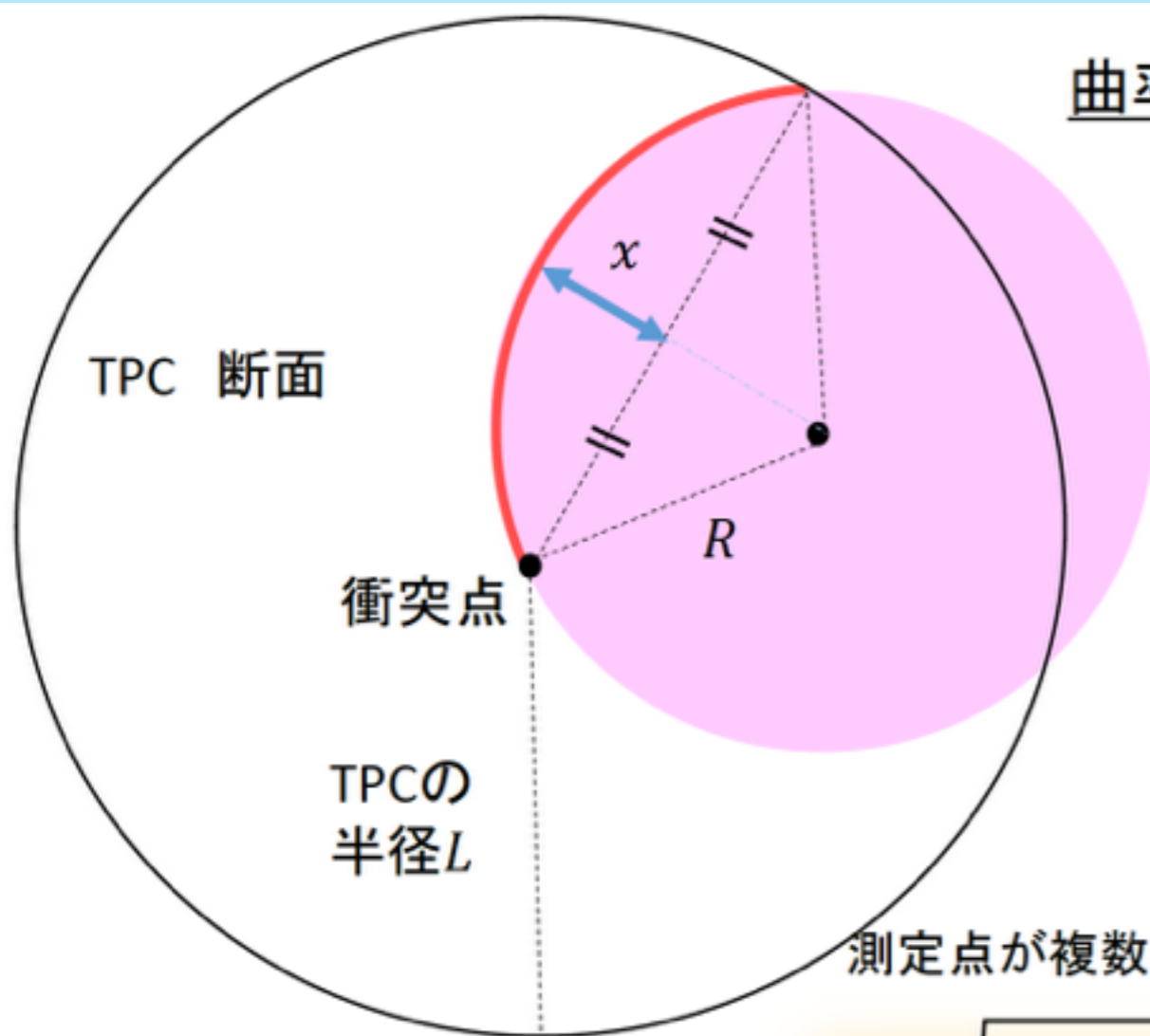
②2飛跡の分離

他の検出器で2つの飛跡を判別できるようにする



シミュレーションで得られたILDの飛跡

運動量測定



曲率半径 R を求める

$$R^2 = (R - x)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \quad R \gg x \text{ とすると} \quad R \approx \frac{L^2}{8x}$$



$$P_T = 0.3BR \approx \frac{0.3BL^2}{8x}$$

$$\frac{\sigma_{P_T}}{P_T} \propto \frac{\sigma_x P_T}{0.3BL^2}$$

測定点が複数あることや多重散乱等を考慮するとより正確には...

運動量分解能

$$\frac{\sigma_{P_T}}{P_T} \simeq \sqrt{\underbrace{\left(\frac{\alpha' \sigma_x}{BL^2}\right)^2 \left(\frac{720}{n+4}\right) P_T^2}_{\text{measurements}} + \underbrace{\left(\frac{\alpha' C}{BL}\right)^2 \left(\frac{10}{7}\right) \left(\frac{X}{X_0}\right)}_{\text{multiple scattering}}}$$

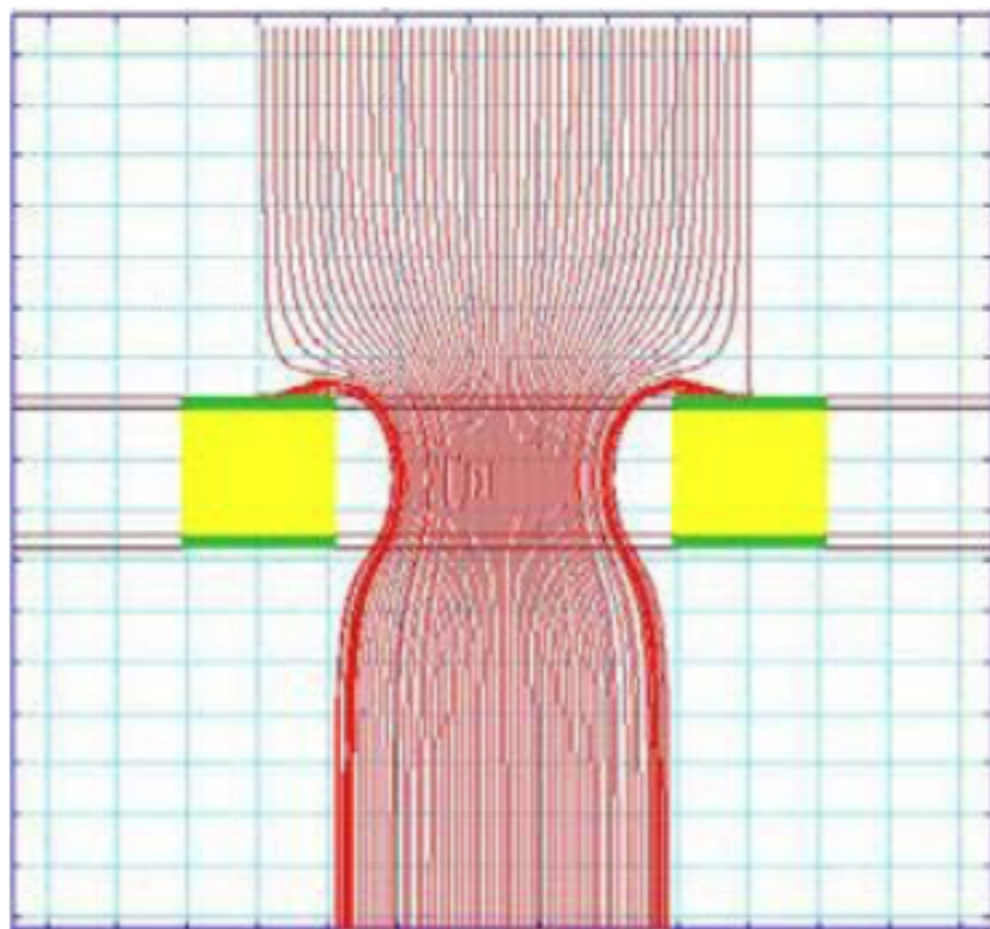
R.L. Gluckstern, NIM 24 (1963), 381

測定点の数: n と位置分解能: σ_x と磁場の強さ: B と 飛跡検出長 L に依存

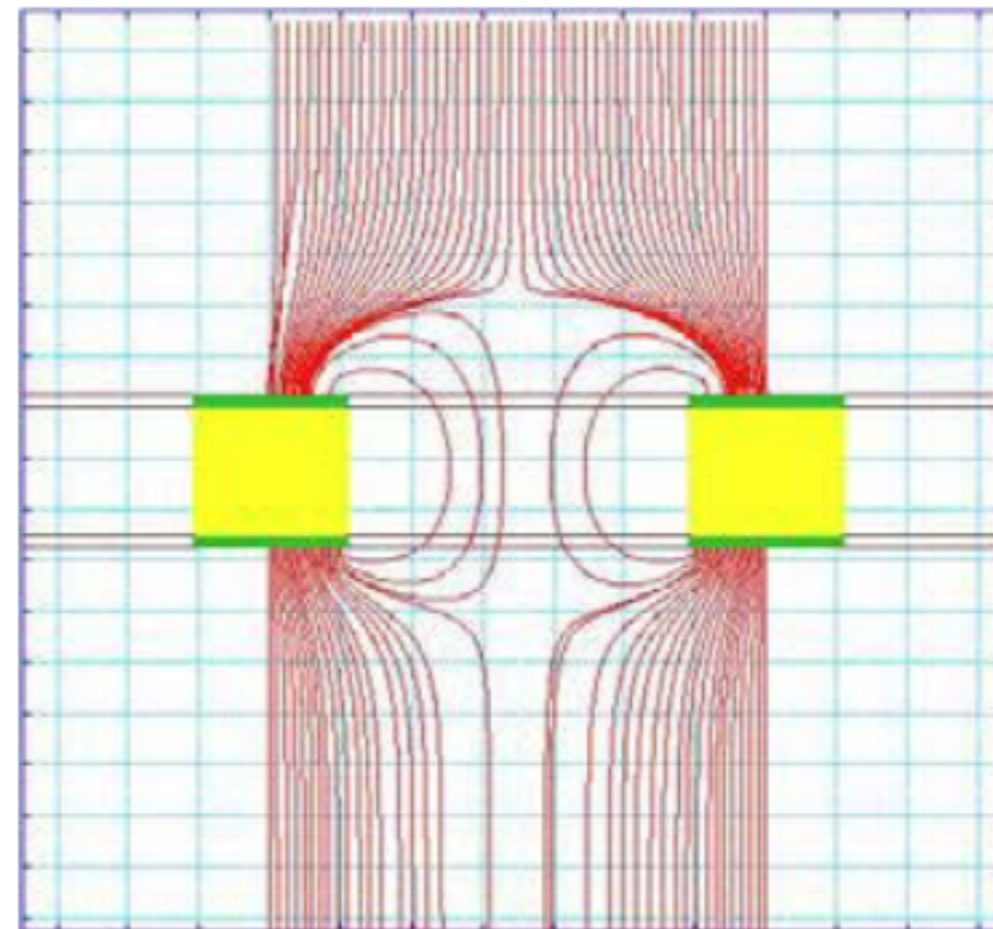
ゲート GEM動作原理



ゲートOpen



ゲートClose



T2Kガス



Ar : CF₄ : iC₄H₁₀ = 95 : 3 : 2

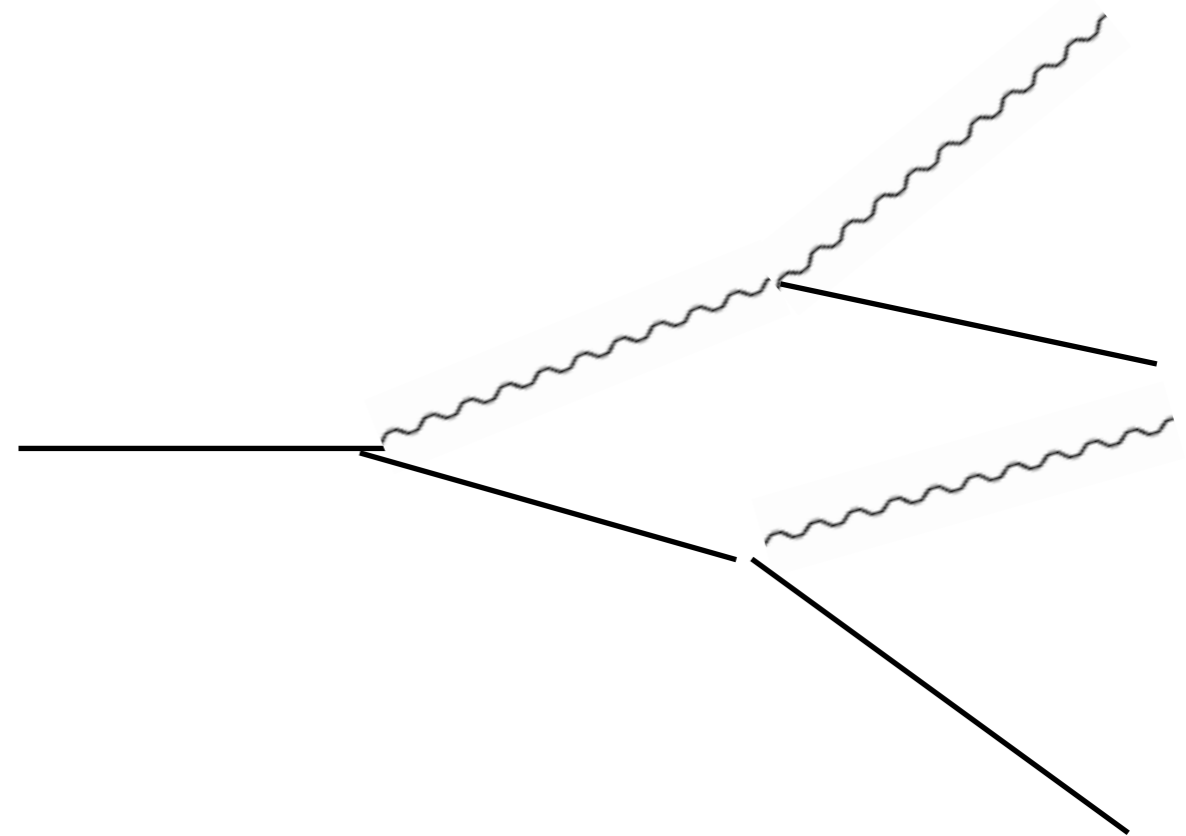
<p>Ar アルゴン</p>	<ul style="list-style-type: none">• 希ガス ⇒比較的 low 電圧でガス増幅率が高くなる
<p>CF₄ フロン</p>	<ul style="list-style-type: none">• 磁場中で電子の横方向拡散を抑制しやすい ⇒位置分解能が良くなる• ドリフト速度が速い• クエンチング作用を持つ
<p>ISO-C₄H₁₀ イソブタン</p>	<ul style="list-style-type: none">• クエンチング作用を持つ• ペニング効果で電子の増幅率を高くする <p><u>ペニング効果</u>: 原子の準安定励起状態がこれよりも小さいイオン化ポテンシャルの分子や原子に衝突すると、イオン化ポテンシャルの低い分子や原子が電離する現象</p>



電子雪崩



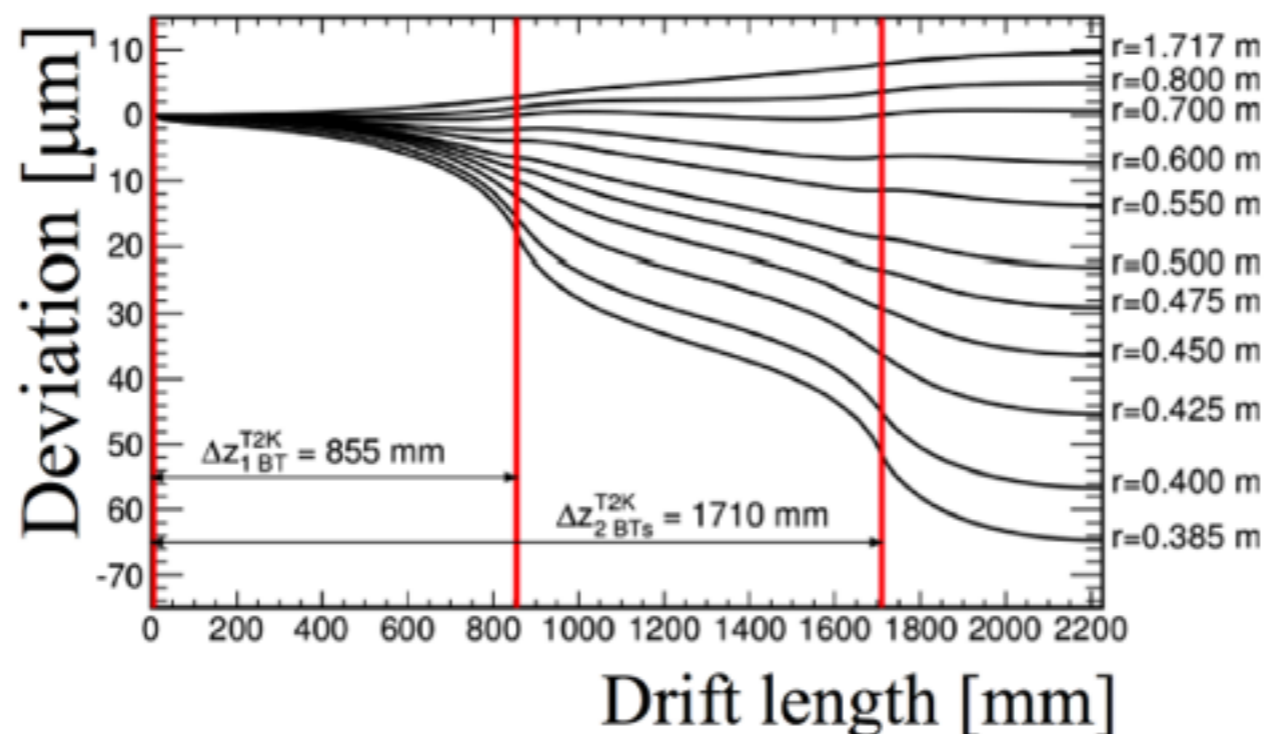
強い電場の中で自由電子が気体分子と衝突すると新たな電子が叩き出され、これが電場で加速されてさらに別の分子と衝突して指数関数的に電子数が増える



イオンフィードバック問題による位置分解能の悪化

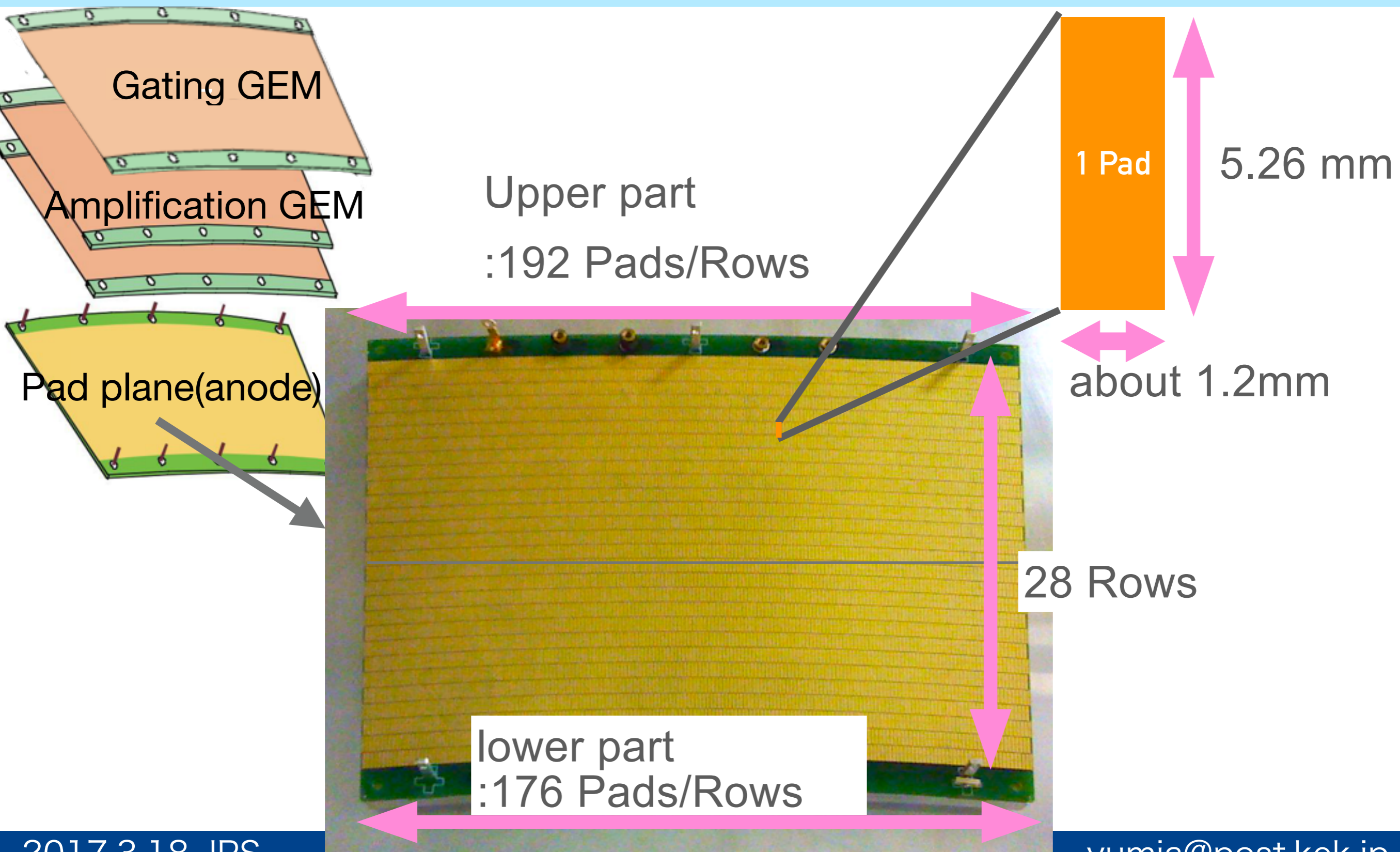


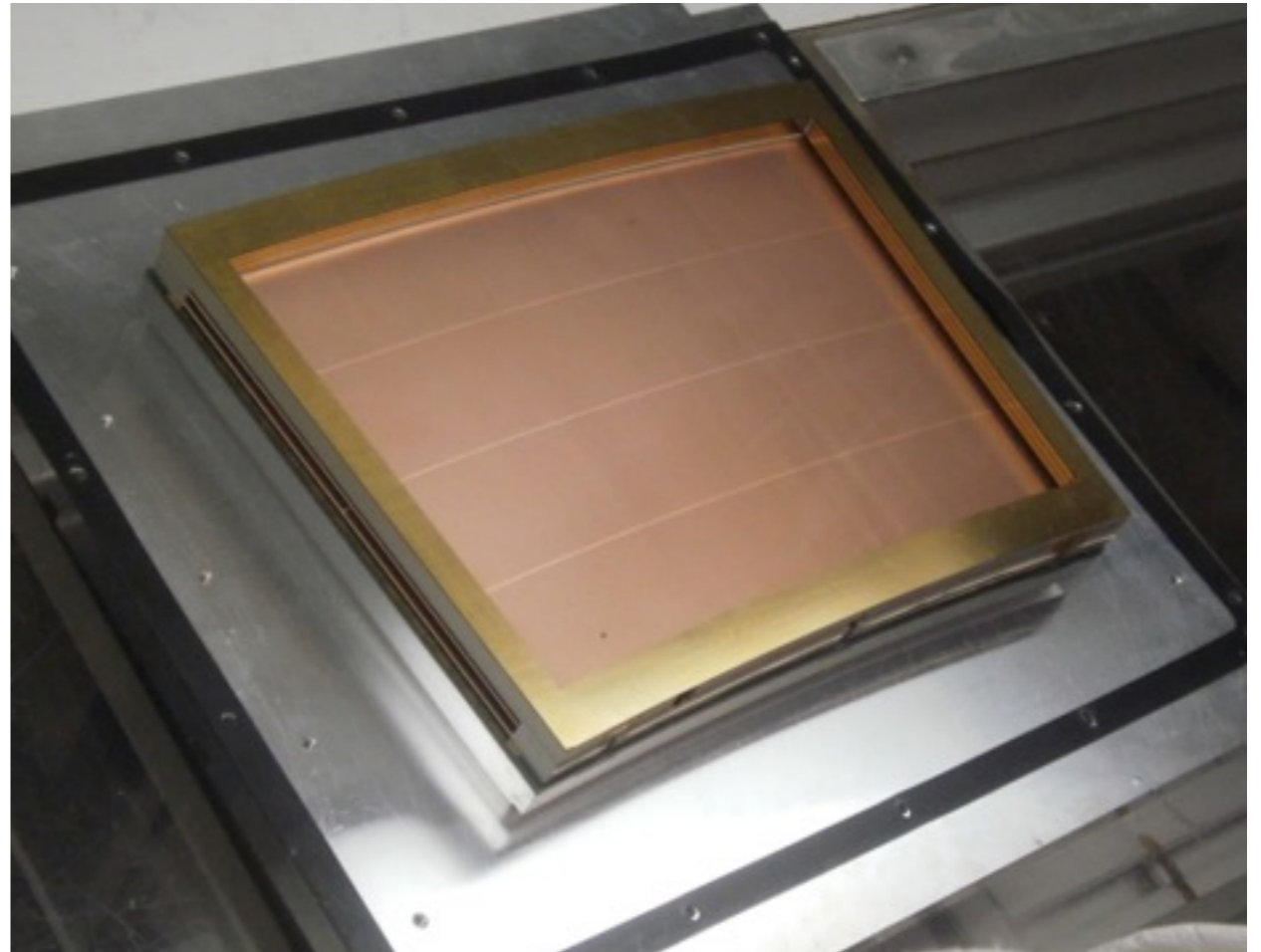
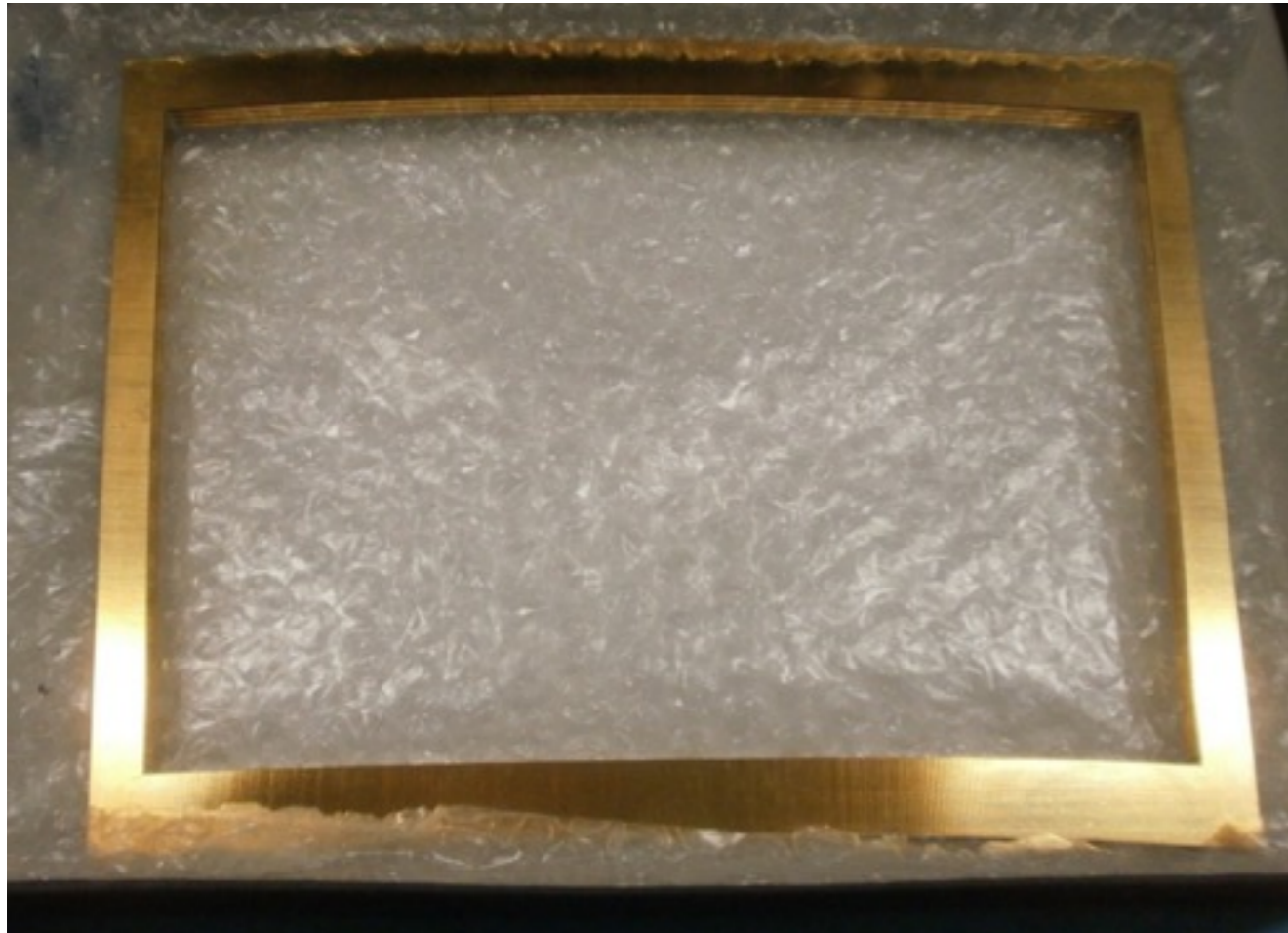
円板状の2次陽イオン群による飛跡ひずみの影響予想図と、
生成陽イオン群による位置分解能への影響
(Ion Back Flow=3)



	ゲート装置なし	ゲート装置あり
1次陽イオン	8.5 μm	8.5 μm
2次陽イオン	60.0 μm	0.01 μm
合計	70 μm	8.5 μm

Readout Pads

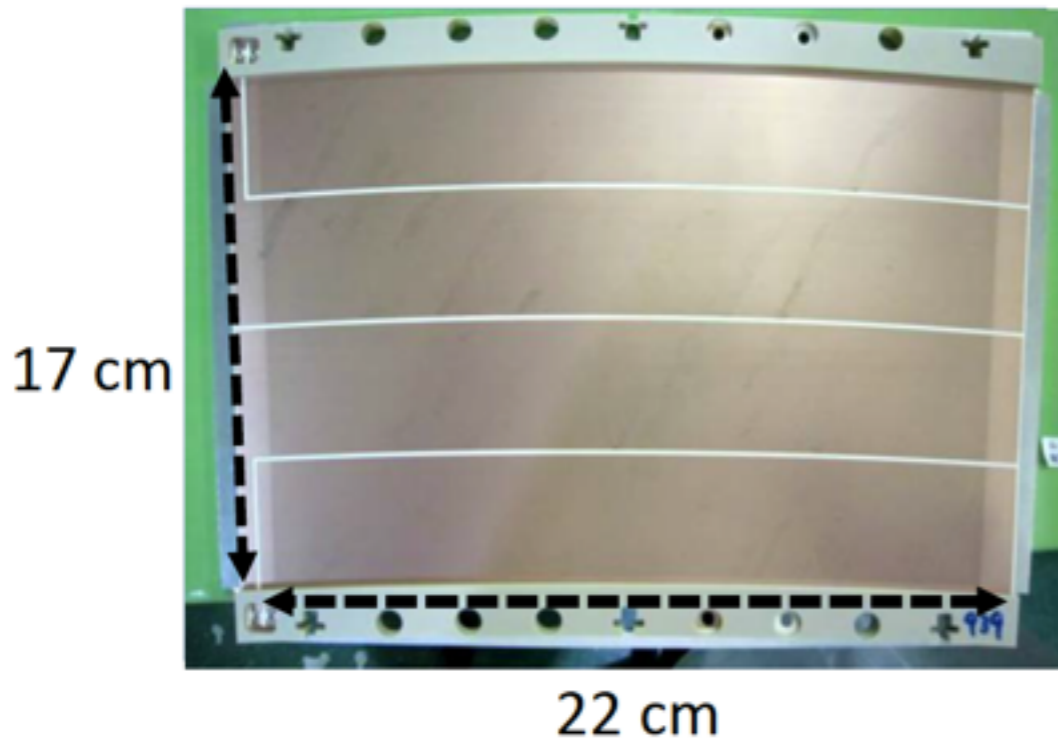




Asian GEM モジュールの構成



GEM module



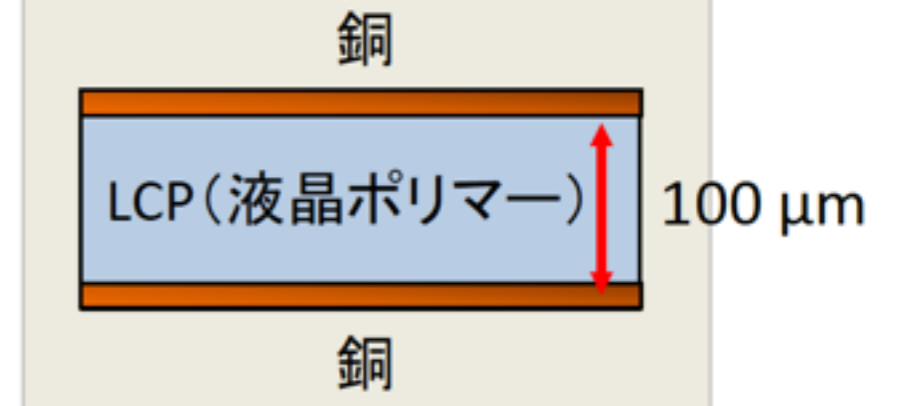
孔の直径

70 μm

細孔間隔

140 μm

横から見た断面図

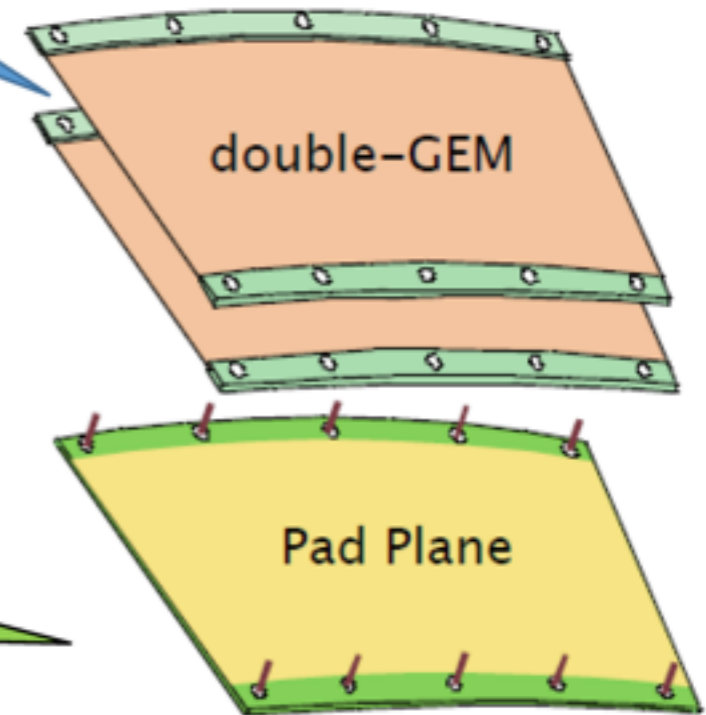


Pad Plane



金メッキされた銅

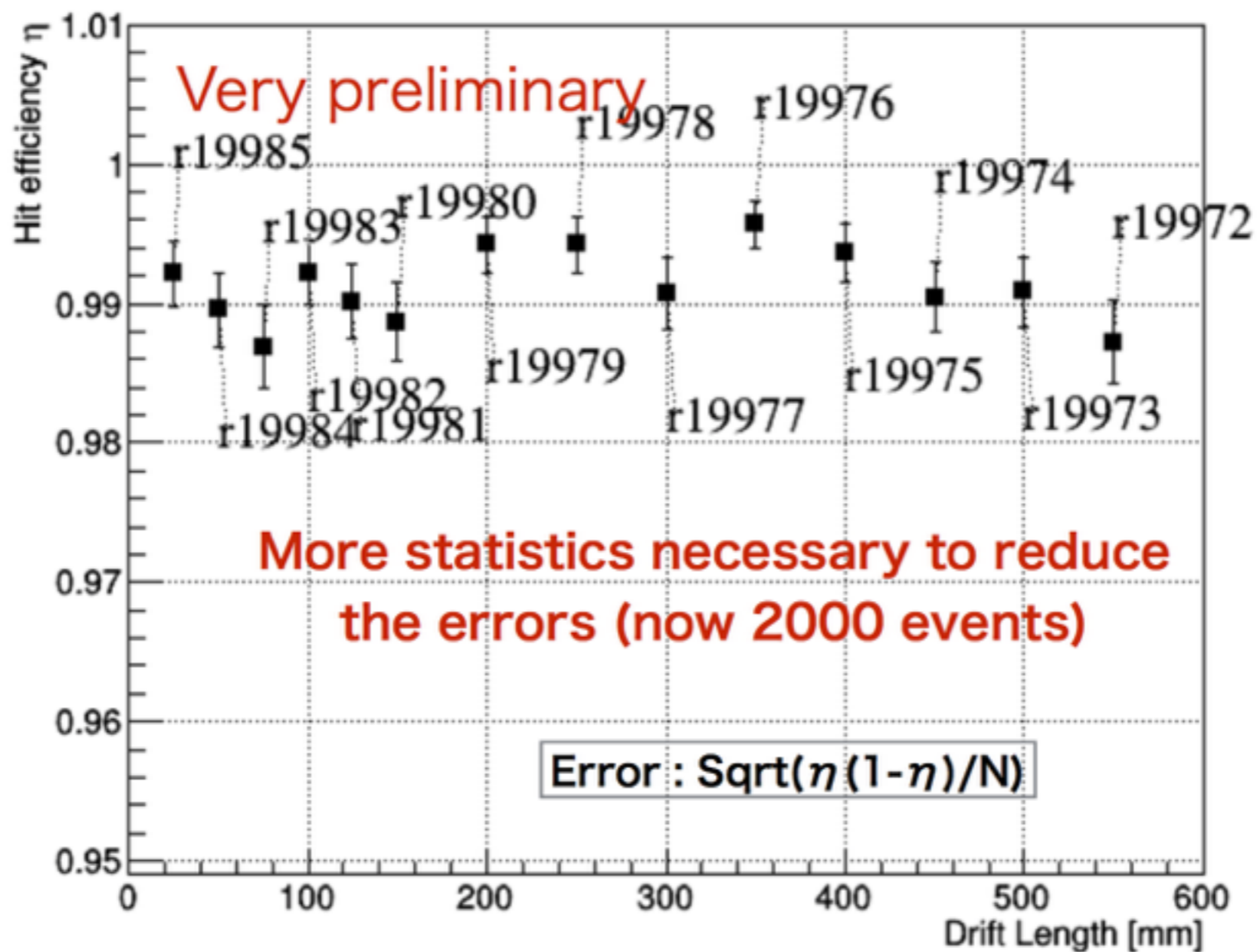
1.15~1.25 mm
5.26 mm
× 5152 pads



Data quality check - Hit efficiency



Hit efficiency (Module3 Row16) **With Gating GEM**



- Missing track is about 1%

Hit efficiency estimation

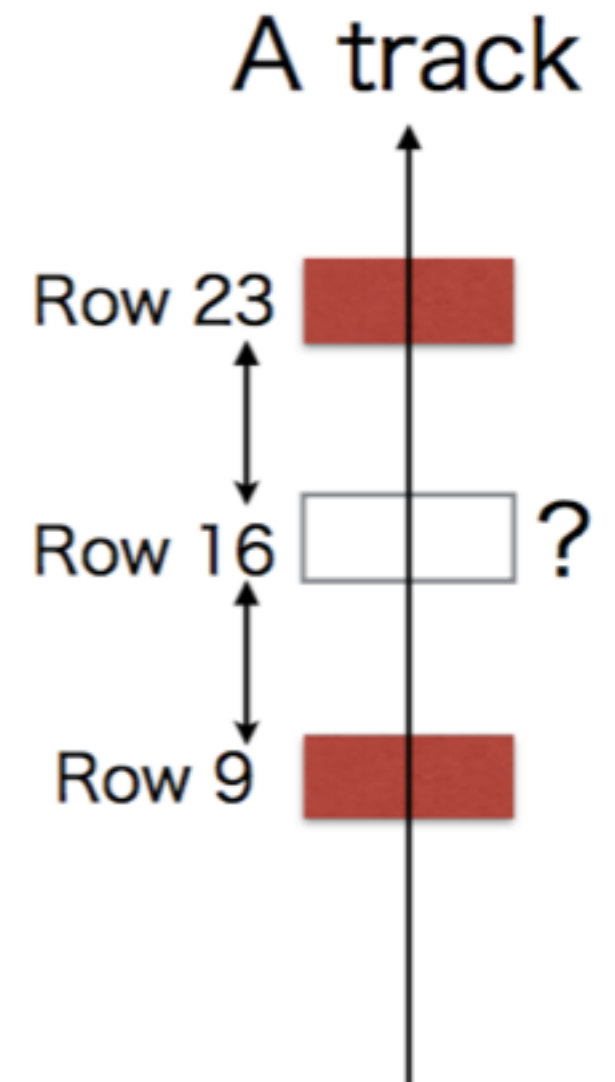
Looked at row-16 (module 3)

7 rows away to avoid effects by the diffusion.

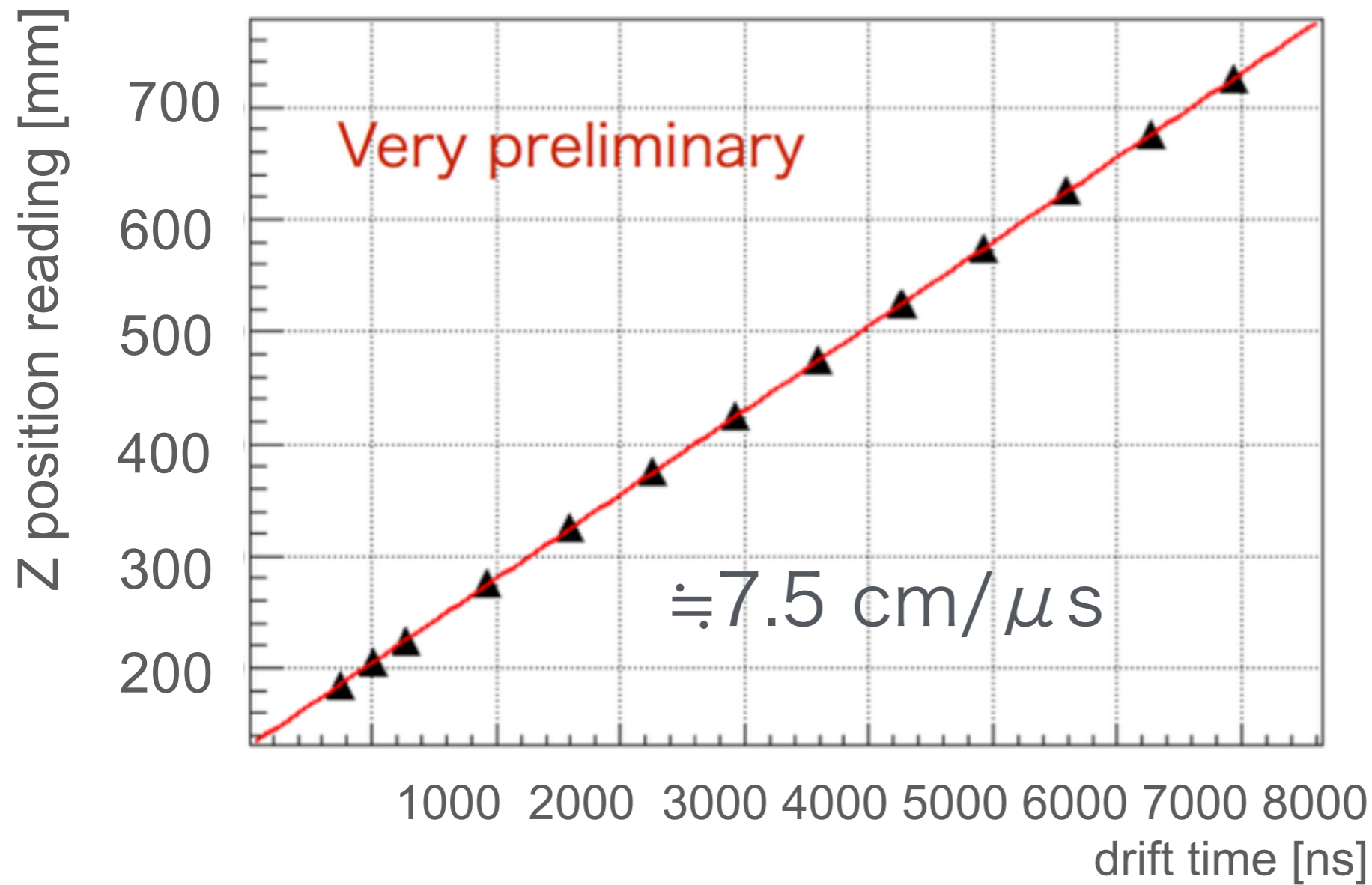
Basic idea :

Test if Row 16 has a hit associated with a track that has hits both on Row 9 and Row 23.

To reduce biases, minimum number of hits per track is set to be a relatively small value (=10) in the track reconstruction step.



データ品質確認 - ドリフト速度



	ゲートあり	ゲートなし
温度 [K]	291.28	290.4
圧力 [hPa]	1010.79	1005.31

Garfieldシミュレーションシミュレーション

ゲートあり 76.7 $\text{cm}/\mu\text{s}$ +/- 0.0013%

ゲートなし 7.68 $\text{cm}/\mu\text{s}$ +/- 0.0022%

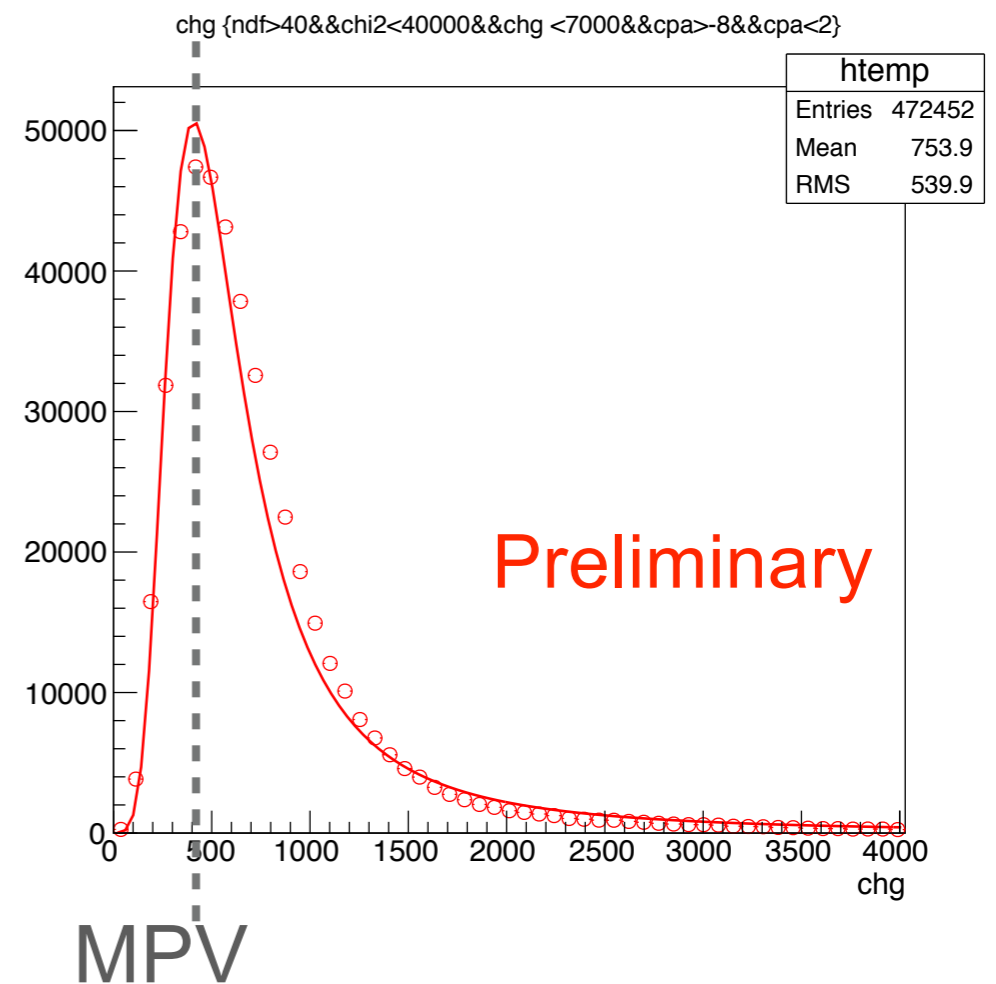
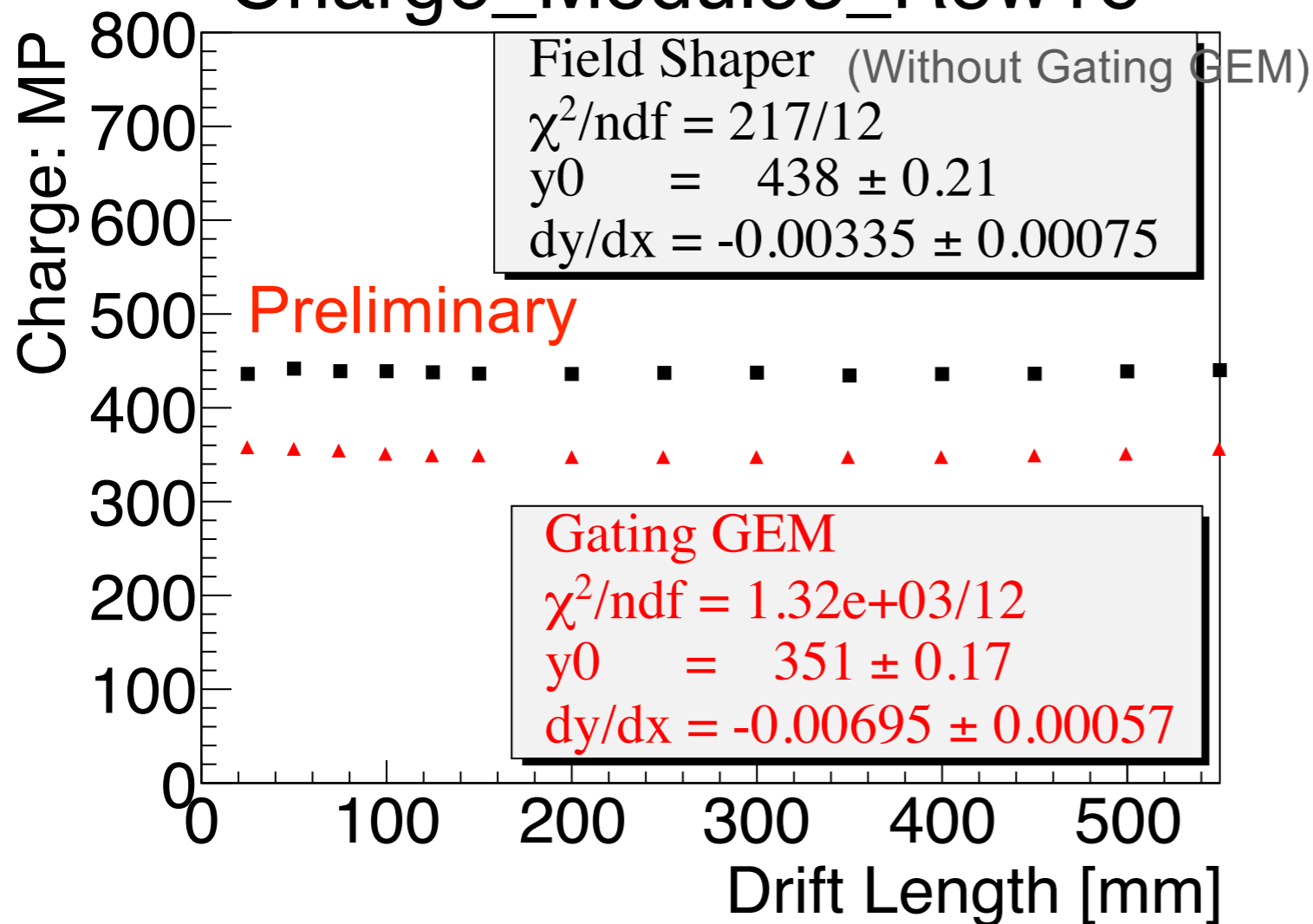
0.00767409 cm/ns +/- 0.0013%

0.00767739 cm/ns +/- 0.0022%

Result - Charge sum

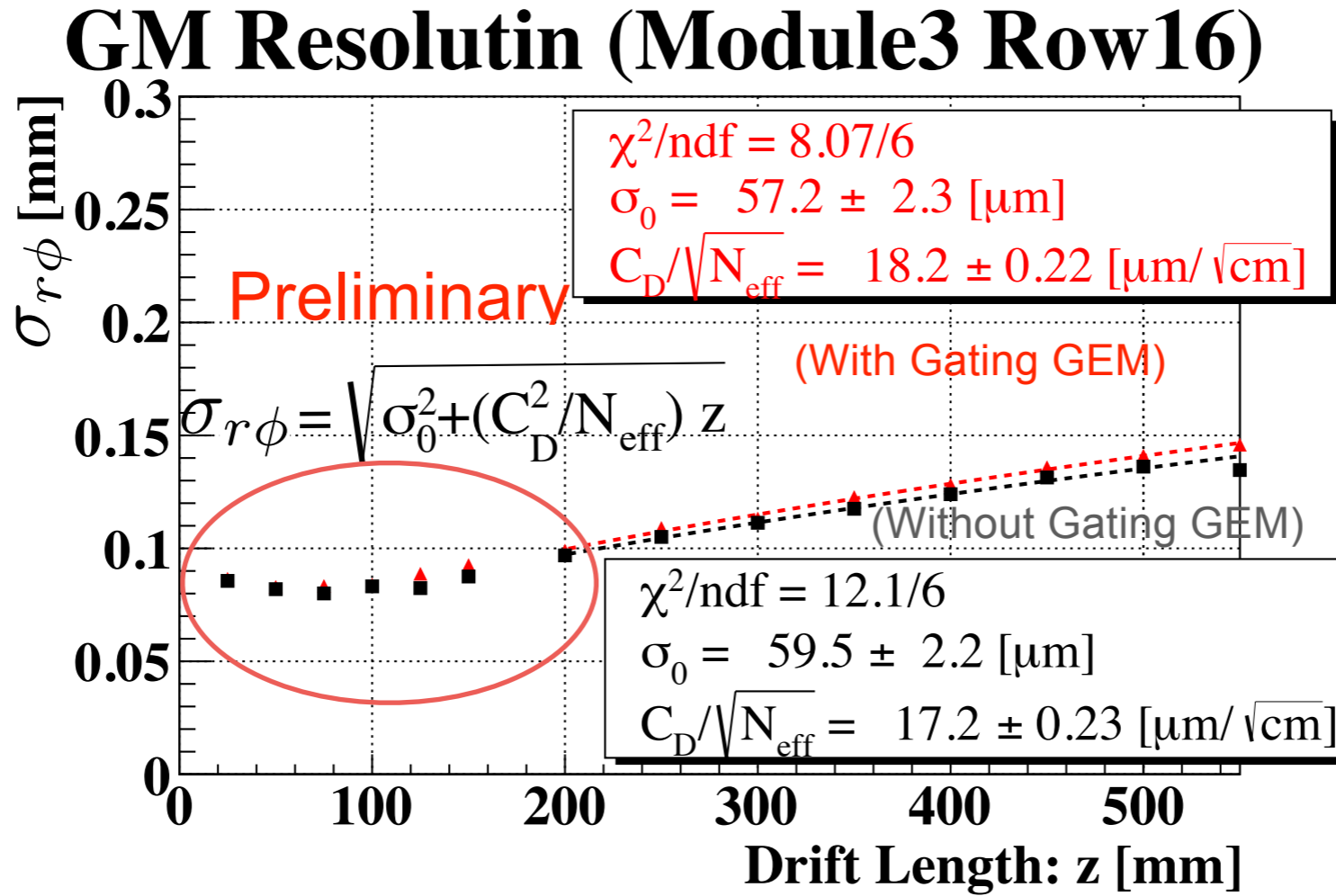


Charge_Module3_Row16



- Optical transparency = 82 %
- There seems to be no electron attachment (P/T correction is not included)

	2.5	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Ratio	82.0	80.4	80.4	79.9	79.7	79.7	79.4	79.2	79.0	79.7	79.6	79.9	79.7	80.6
/%	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.2



ホドスコープ (Hodoscope) とは飛跡検出器の一種
 ストリップ状シンチレータなどを用いて (重心法を用いずに) トラッキング
 を行う検出器
 よって、シングルパッドヒットによる効果をホドスコープエフェクトと呼ん
 でいる

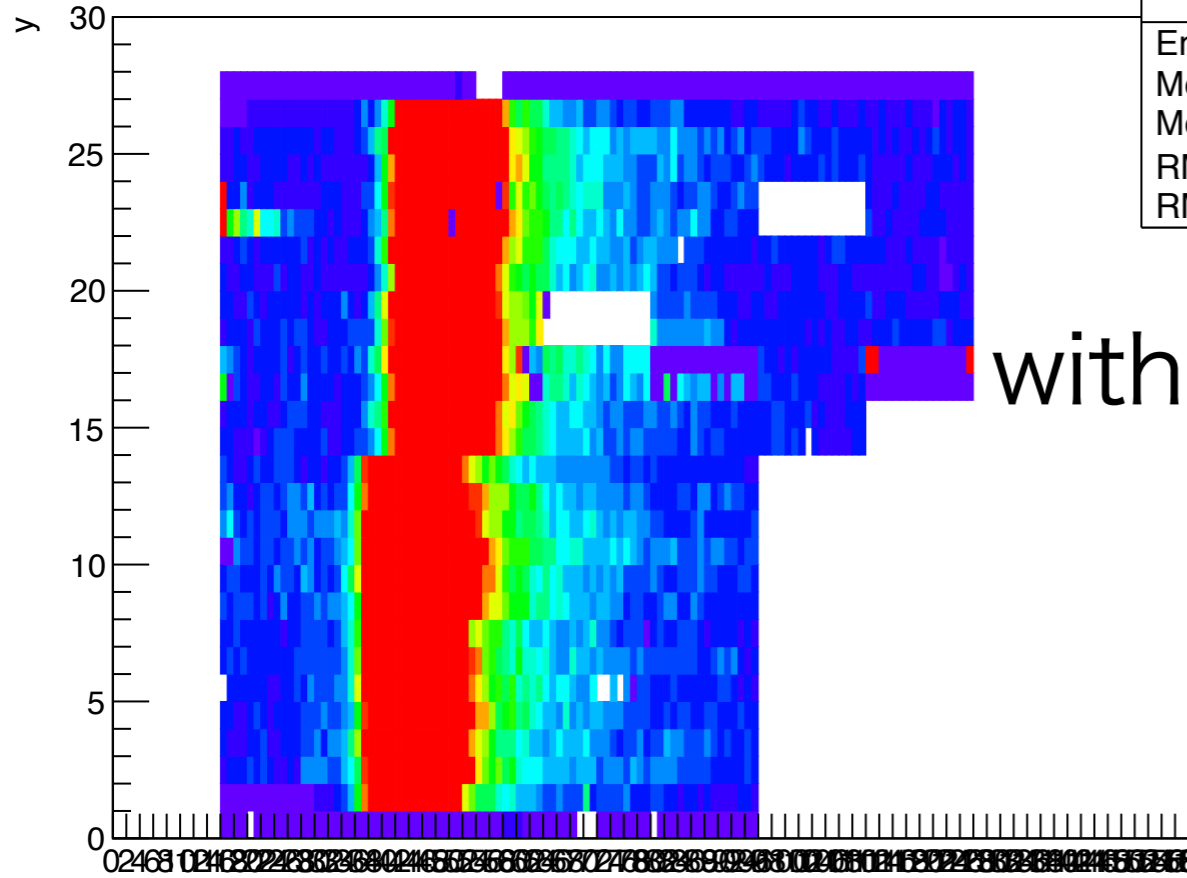
パッドレスポンス



Charge-weighted hit position

hTrackPos	
Entries	1095056
Mean x	53.62
Mean y	13.71
RMS x	19.36
RMS y	7.283

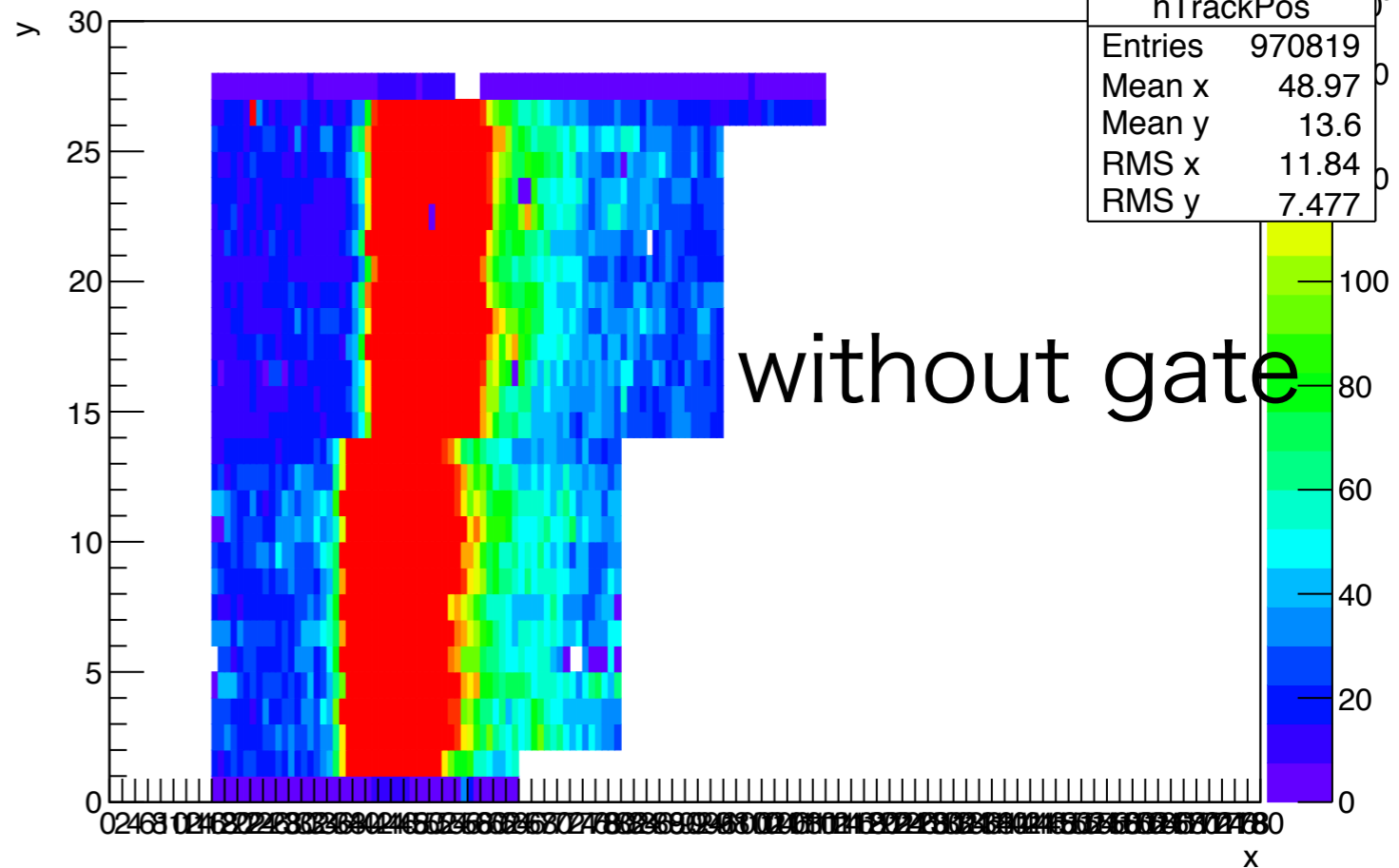
with gate



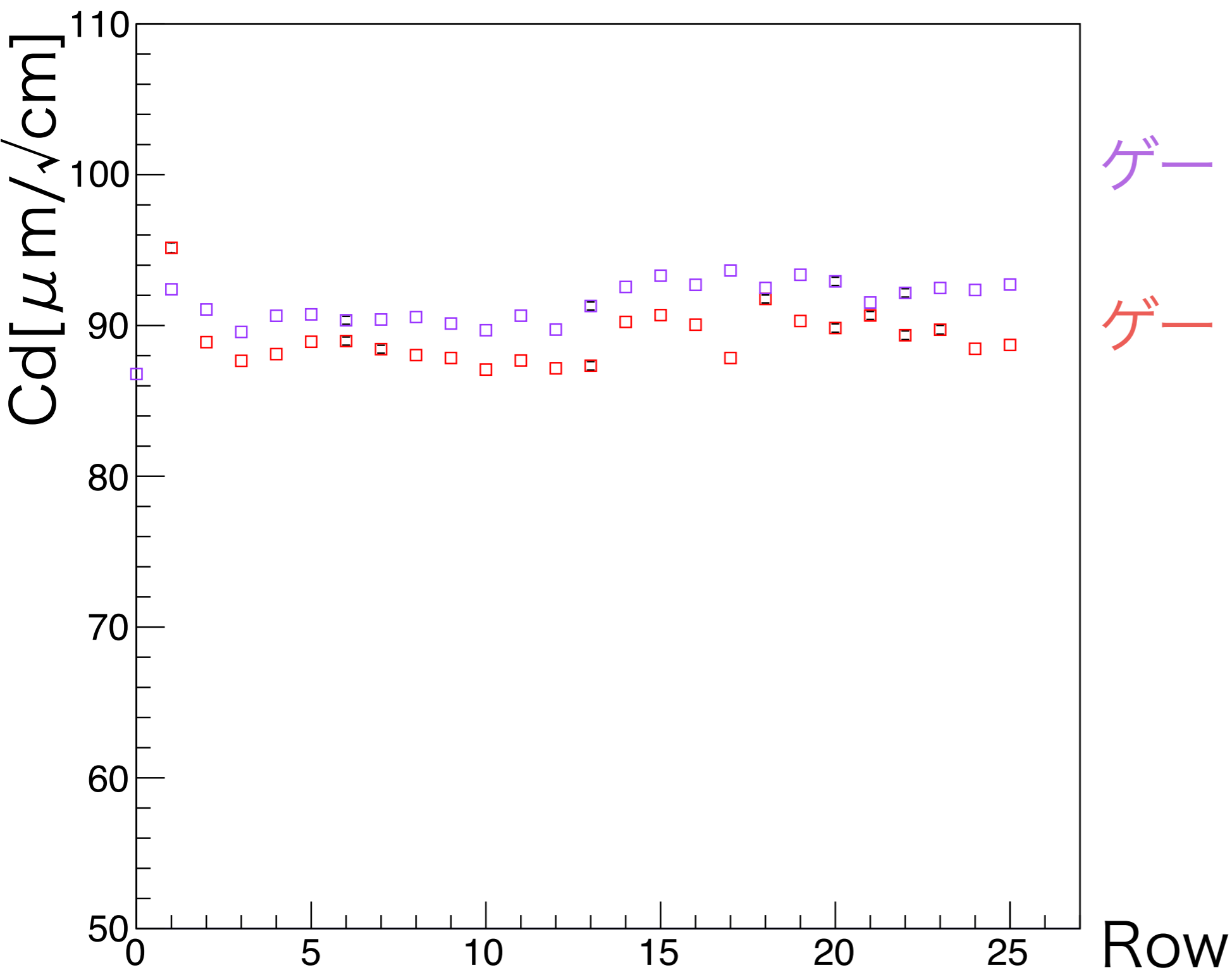
Charge-weighted hit position

hTrackPos	
Entries	970819
Mean x	48.97
Mean y	13.6
RMS x	11.84
RMS y	7.477

without gate



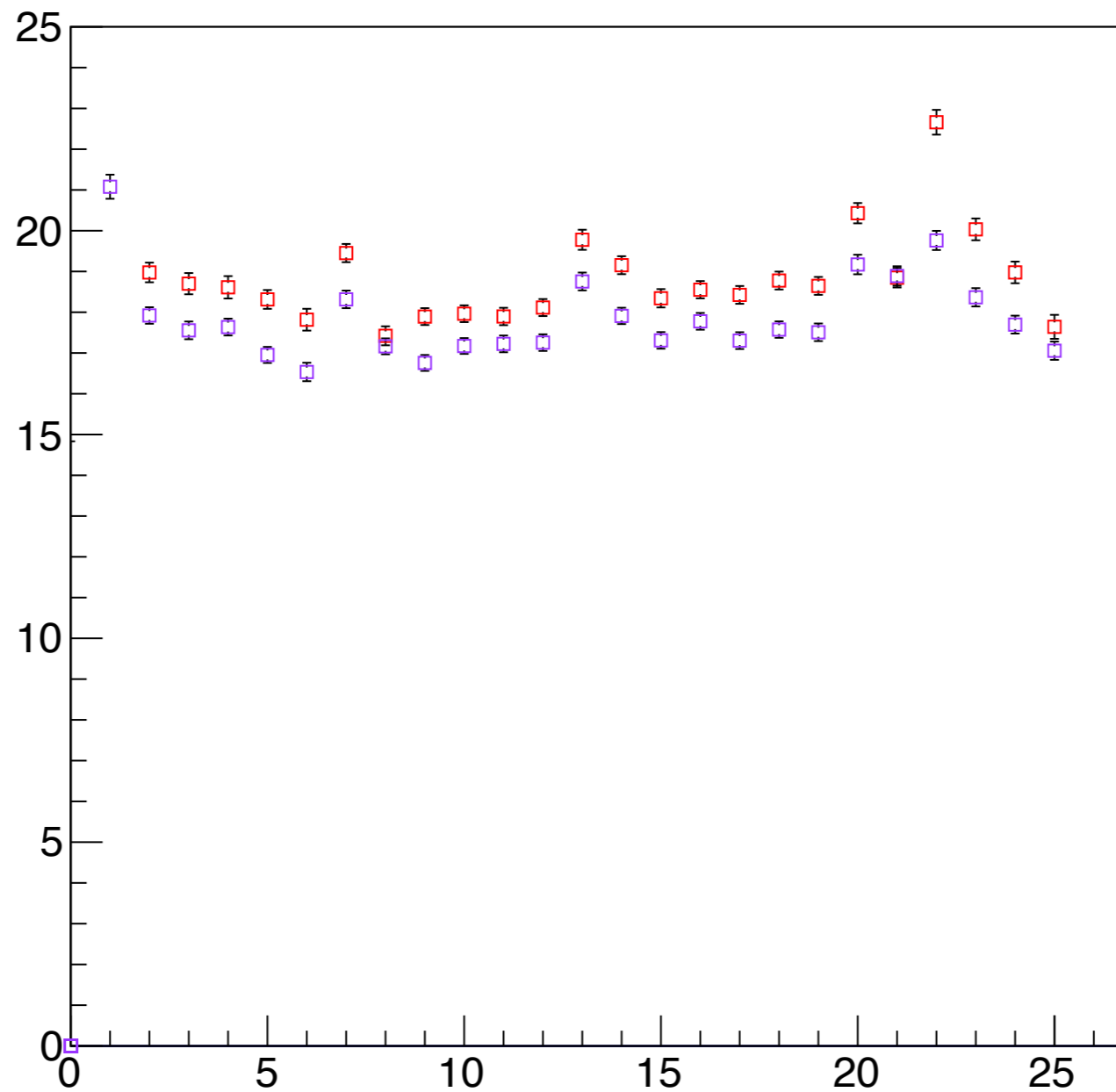
Row依存性 Cd



ゲートなし module3

ゲートあり module3

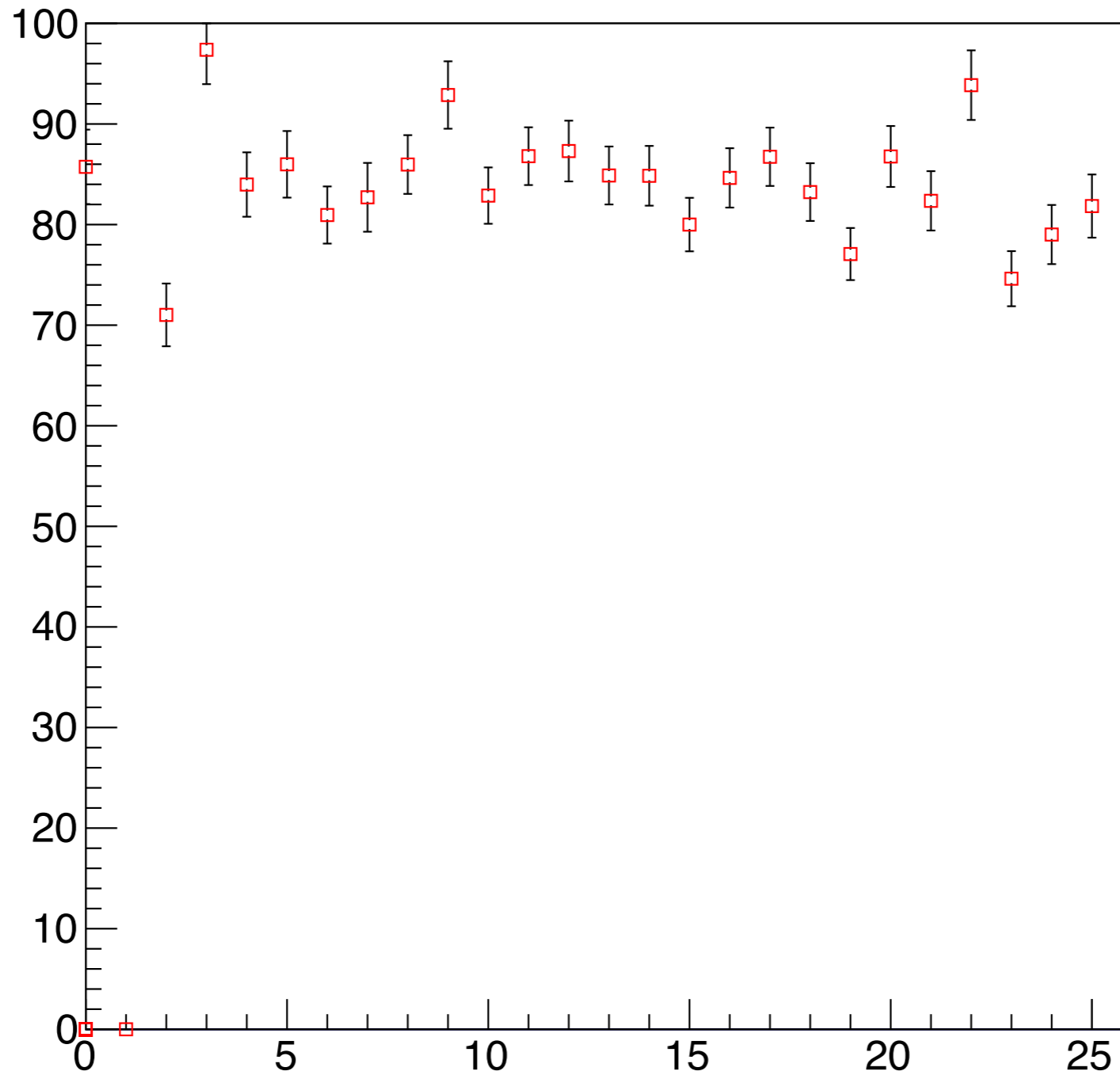
Row依存性 $Cd^2/\sqrt{N_{eff}}$



Row依存性 Neff



Row依存性 透過率



予想：110%



$$\sigma_{r\phi} = \sqrt{\sigma_0^2 + \frac{(C_D^2)}{N_{eff}} z}$$

N_{eff} が80%になるとすると

$$\text{比率} = \sqrt{1/0.8}$$

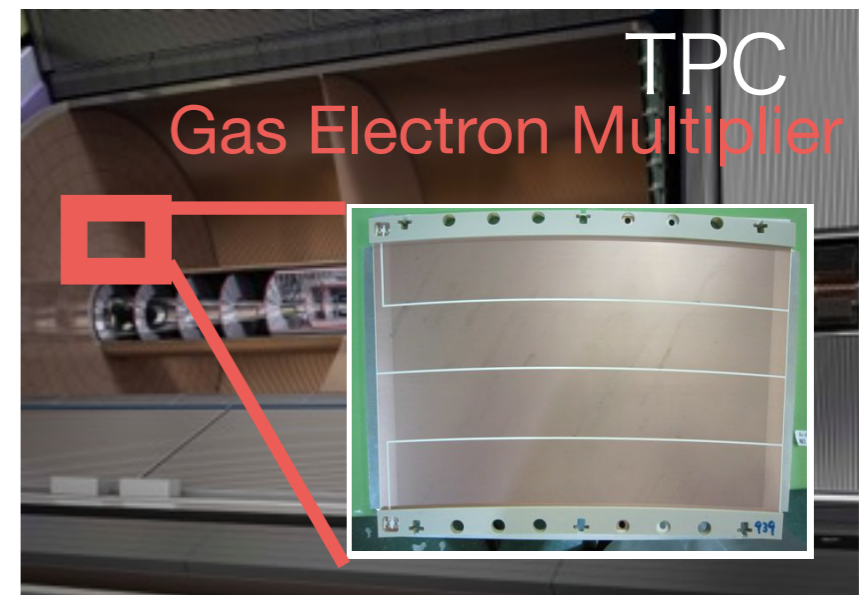
$$= \sqrt{1.25}$$

$$= 1.1$$

前回のビーム試験の問題点

TPCに要求されること

- ・ 高い運動量分解能
- ・ PFAを可能にする高い飛跡認識能力



TPC大型プロトタイプビーム試験施設 (@DESY)

前回のビーム試験 (2010) : $Z=2.2\text{m}$ で $100\mu\text{m}$ 以下の位置分解能を達成

陽イオンフィードバック問題

今回のビーム試験の目的

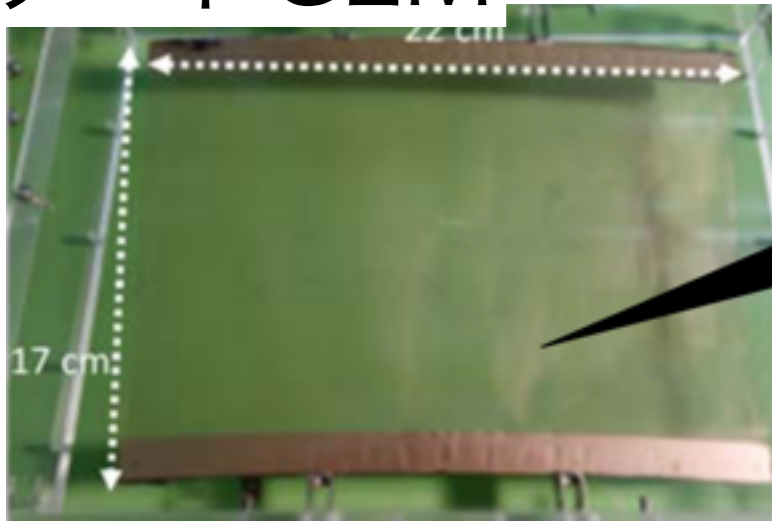
陽イオンフィードバック問題

電離によって大量に発生した陽イオンが電場を歪ませ、位置分解能が悪化

カソード側に陽イオンが戻ってこない、

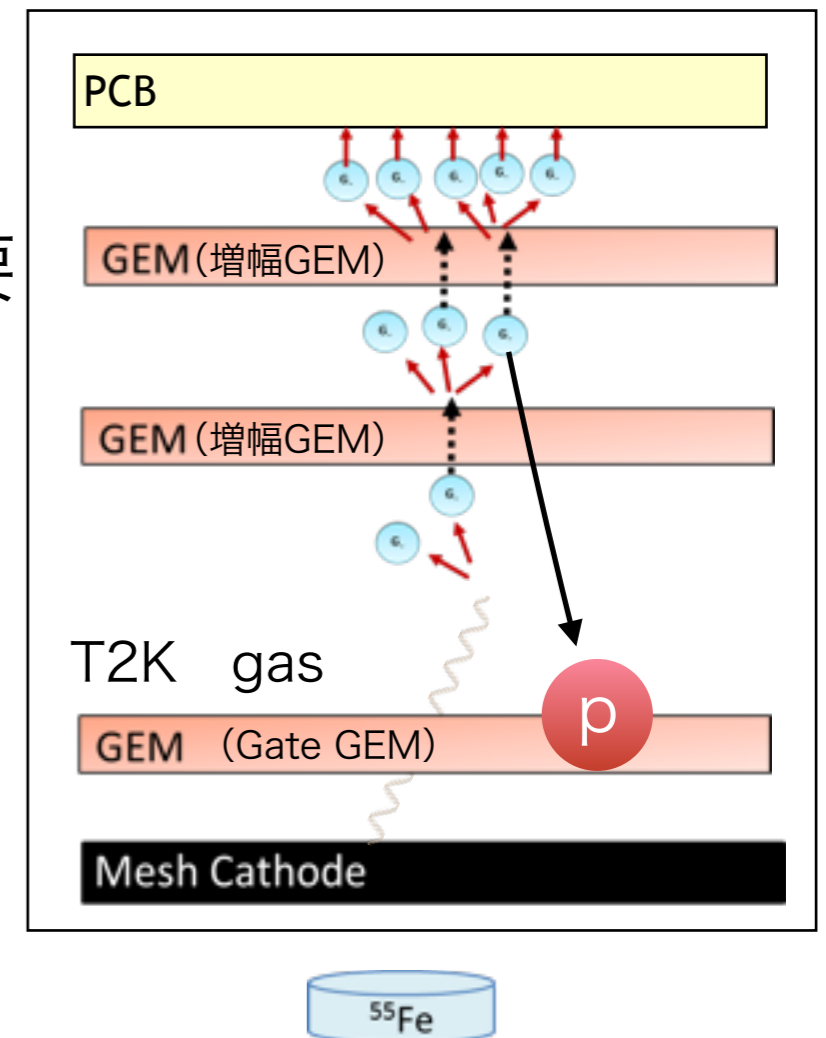
電子透過率80%を達成できる高開口度のゲートが必要

ゲートGEM



世界初

- ・非常に薄く、開口度の高いゲートとしてのGEM



今回のビーム試験 (2016.10～) : ゲートGEMを搭載

ビーム試験に向けた準備

目的：DESYでのビーム試験での動作条件の決定

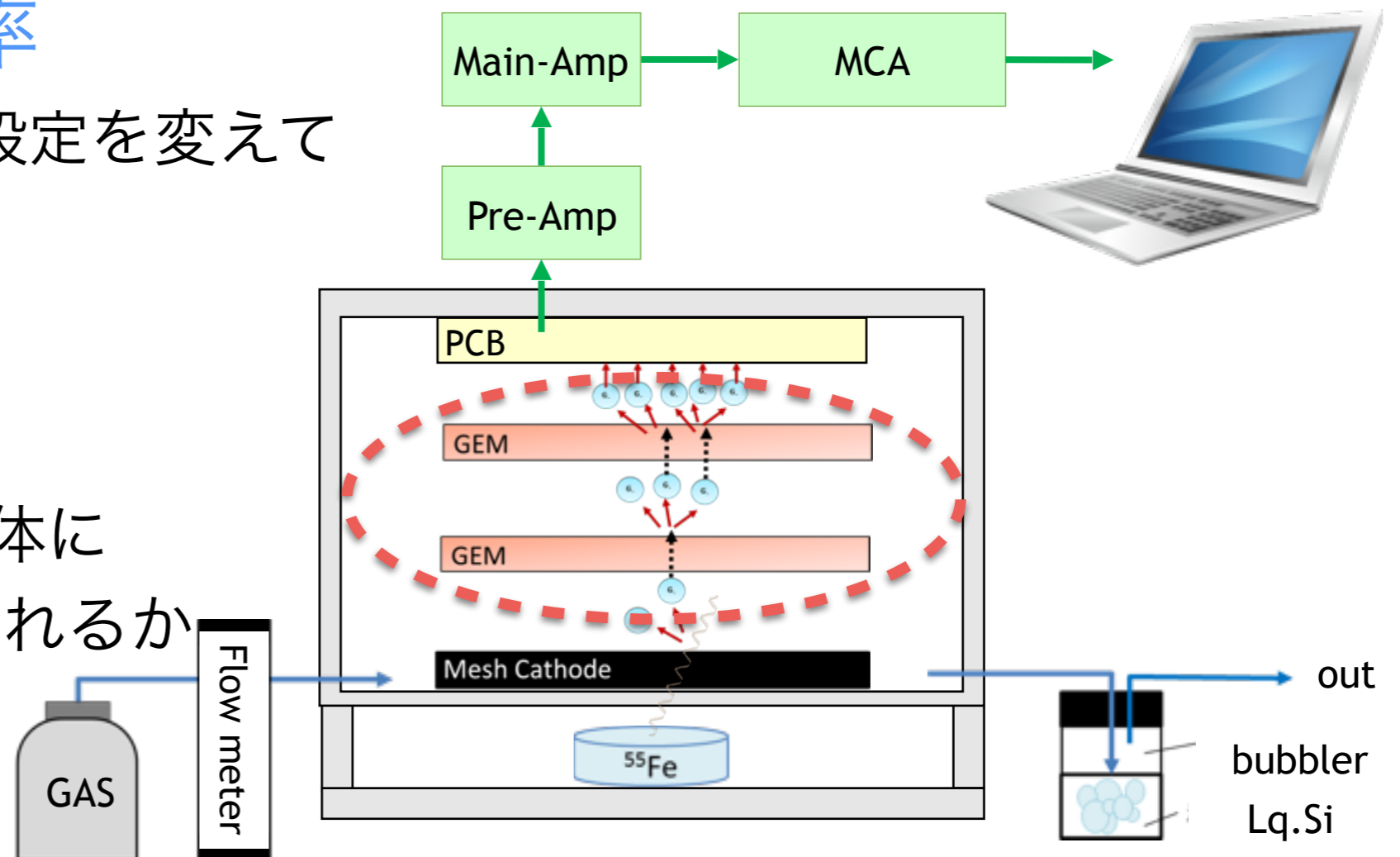
(ゲートGEMが放電が少なくかつ十分なS/N比が得られる)

① 増幅率と放電率

GEMにかける電圧設定を変えて
測定を行う

② 均一性

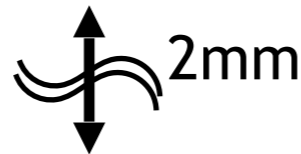
その電圧設定で全体に
均一な増幅率が得られるか



実験：増幅率と放電率の測定

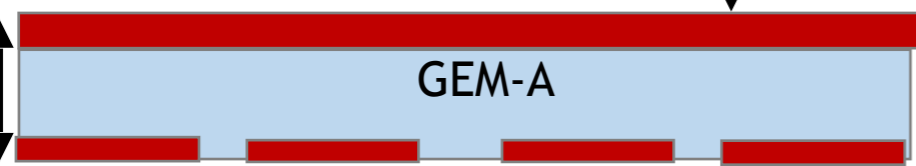
～GEMの断面図～

Anode



2mm

100 μm



GEM-A



VGEMup

335,340,345,350,355V

315,320,325,330V

100 μm



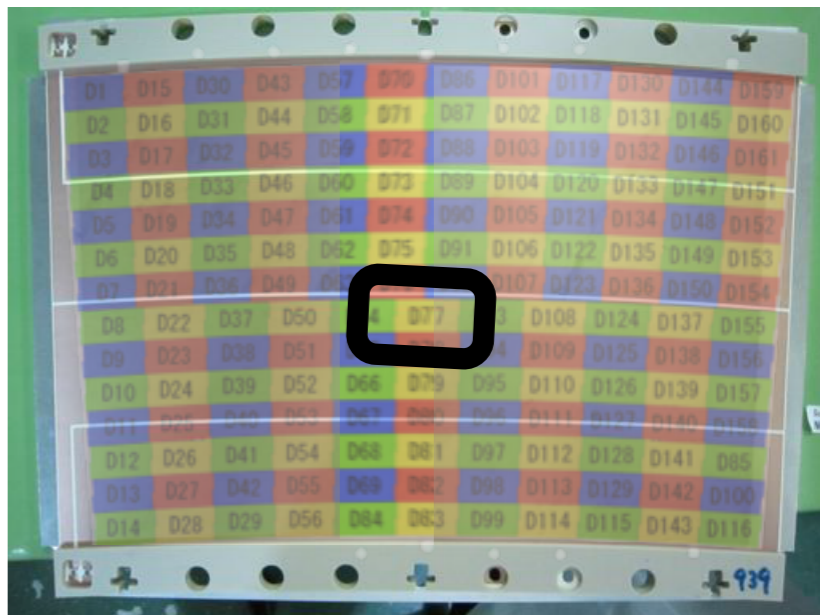
GEM-C



VGEMdown

Field shaper

Cathode



Position

5分間測定

※2組のGEMについて測定

放電率：1つのGEMの上下面の電流をモニター→安定値から同時に動いたら、放電があったとみなす（30分測定）

結果・考察：増幅率と放電率

Pair-1 comparison on D77

		$V_{GEMdown}$ [V]			
		315	320	325	330
V_{GEMup} [V]	335	No measurement			
	340	<u>1685</u>		Discharge lot <u>2815</u>	×
	345	<u>2377</u>	discharges little <u>2755</u>	Discharge lot <u>3093</u>	×
	350	2769		×	×
	355	<u>3252</u>	There will be many discharges		

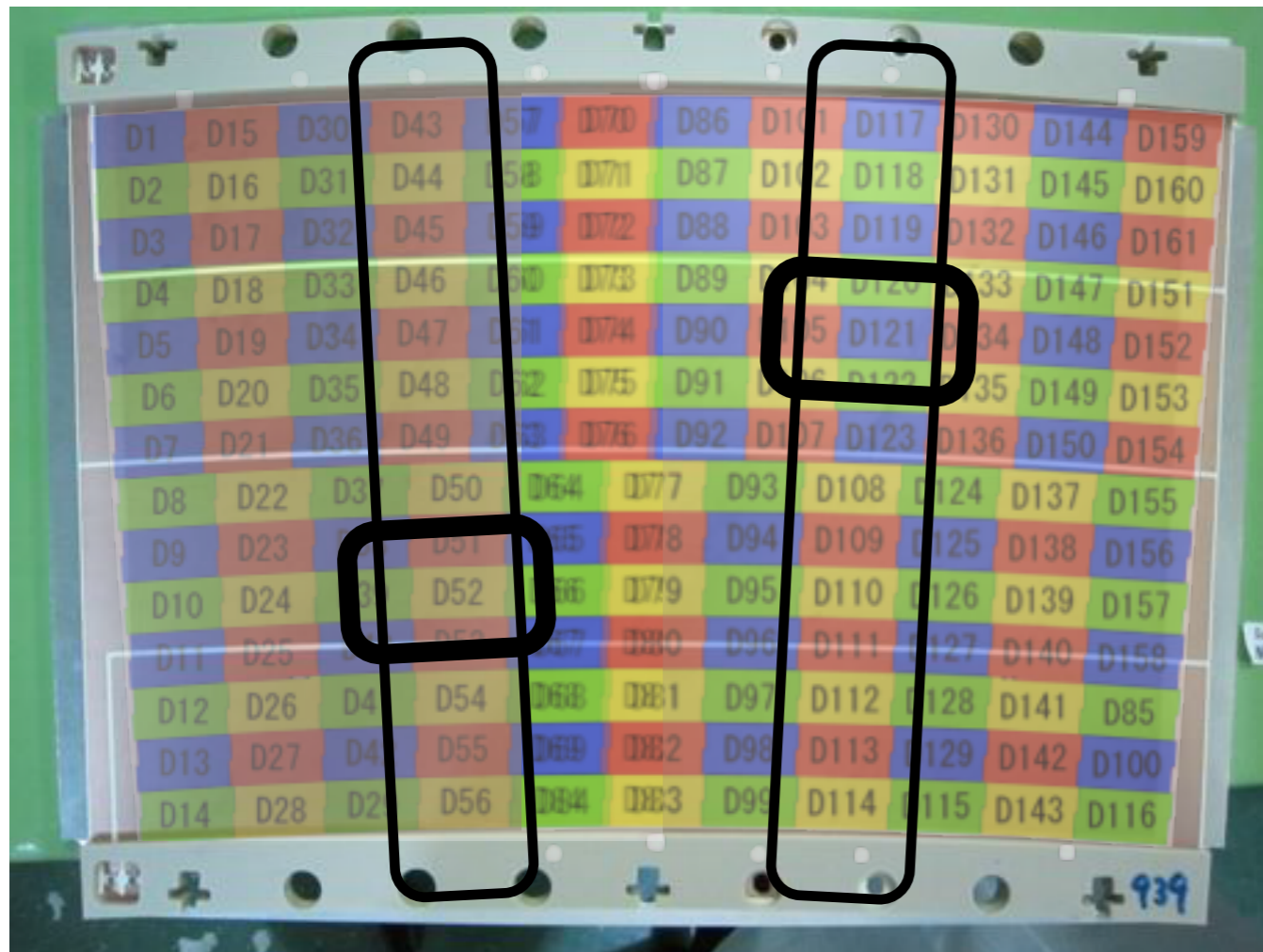
Pair-2 comparison on D77

		$V_{GEMdown}$ [V]			
		315	320	325	330
V_{GEMup} [V]	335	2262	No measurement		
	340	2474	3032	Discharge Lot <u>3736</u>	×
	345	<u>2860</u>	Discharge Little <u>3427</u>	×	×
	350	<u>3446</u>	discharges little ? 4230	×	×
	355	<u>4226</u>	There will be many discharges		

pair2のほうが比較的高い増幅率で少ない放電率である

実験：均一性

Position/Connector numbers



Pair2

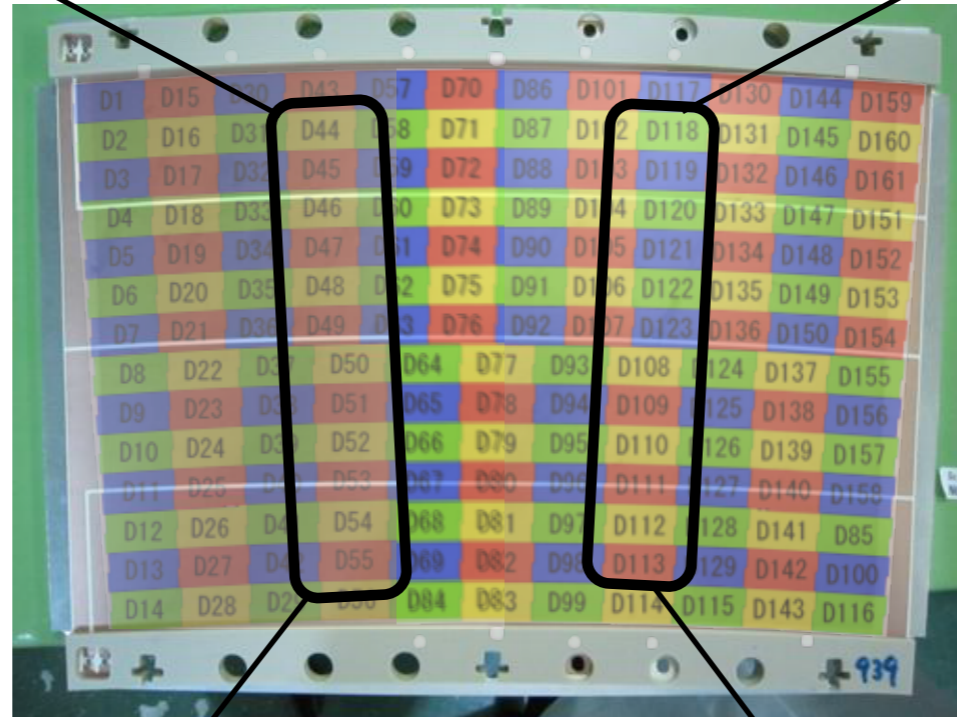
(VGEMup:345 V
VGEMdown:315 V

2列を測定

装置内のH₂O, O₂量の変化を
考慮に入れた補正を行うため、
2箇所測定を行うごとに
参照値の箇所を測定

結果：均一性

	GAIN	Resolution
D44	2807	0.15
D45	2405	0.09
D46	2302	0.10
D47	2105	0.09
D48	2163	0.09
D49	2245	0.08
D50	2365	0.08
D51	2427	0.09
D52	2554	0.13
D53	2177	0.09
D54	2293	0.08
D55	2551	0.09



	GAIN	Resolution
D118	2807	0.09
D119	2669	0.10
D120	2419	0.10
D121	2875	0.08
D122	3086	0.08
D123	2647	0.09
D108	2640	0.08
D109	2908	0.09
D110	3158	0.17
D111	2609	0.10
D112	2346	0.10
D113	2745	0.08

增幅率变化：2456±14%

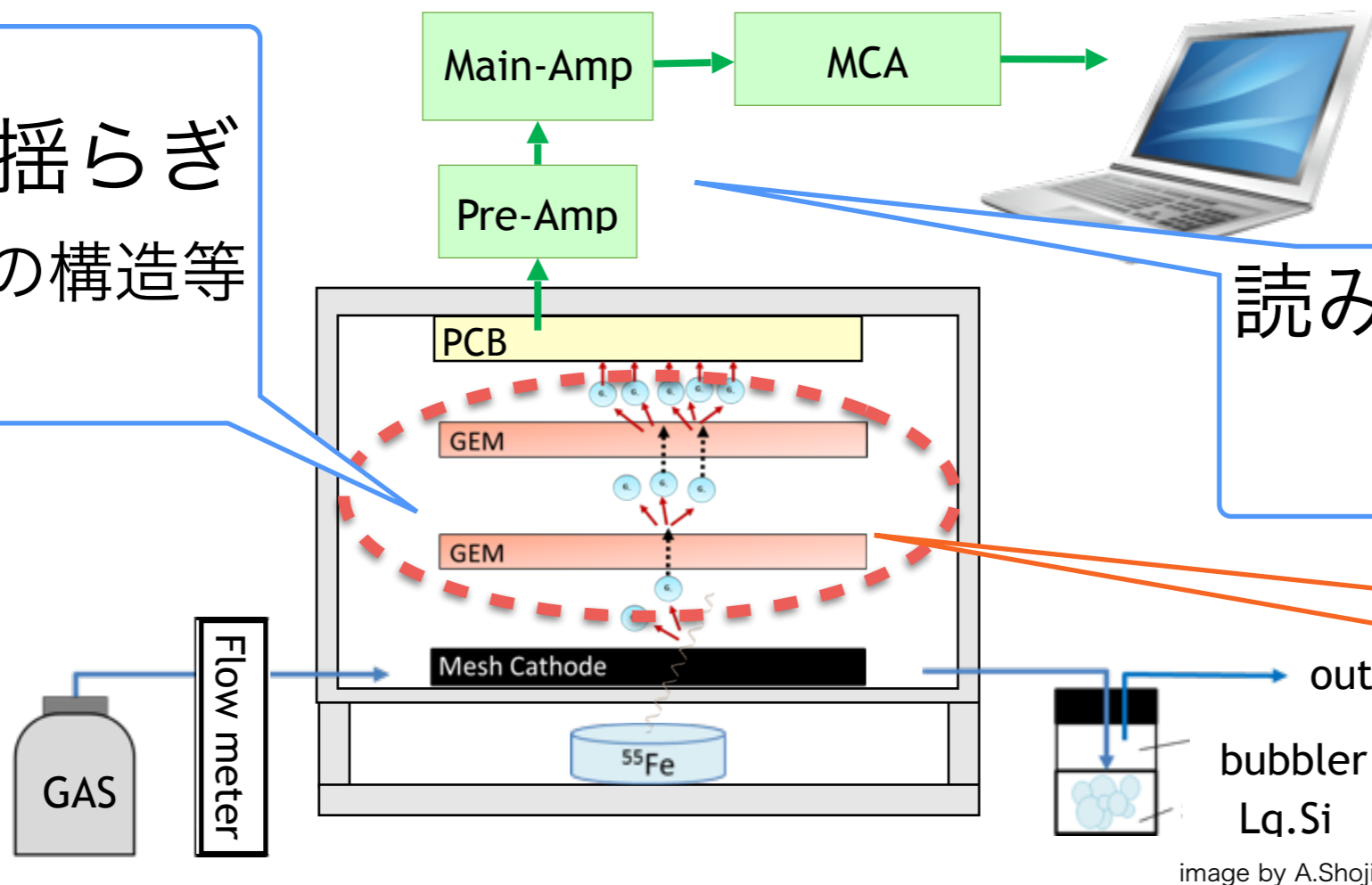
增幅率变化：2752±15%

考察：均一性

GEMが均一でなくなる原因

物理で決まっていない原因で信号測定の精度が悪化している可能性がある

ガスゲイン揺らぎ
・ 増幅 GEM の構造等



読み出しエレキの
ノイズ

GEMの厚さの
不均一性

GEMの厚さについて

GEM2枚で増幅率約2500倍



GEM1枚で増幅率約50倍

GEM1枚で起こる電子雪崩の回数は

$$2^n = 50 \quad 5 < n < 6$$

より5回

GEMの厚さは $100\mu\text{m} \rightarrow 20\mu\text{m}$ 薄くなると

増幅率が $1/2$ になる

課題：GEMの厚さによってどれだけ増幅率が変わるかのシュミレーション

まとめと課題

DESYのビーム試験に用いる予定のGEM に対して安定動作し十分な増幅率を出せる電圧設定を理解した

- 増幅率と放電率

Pair2 > pair1

H.V.の組み合わせ : VGEMup345V、VGEMdown315V

- 均一性

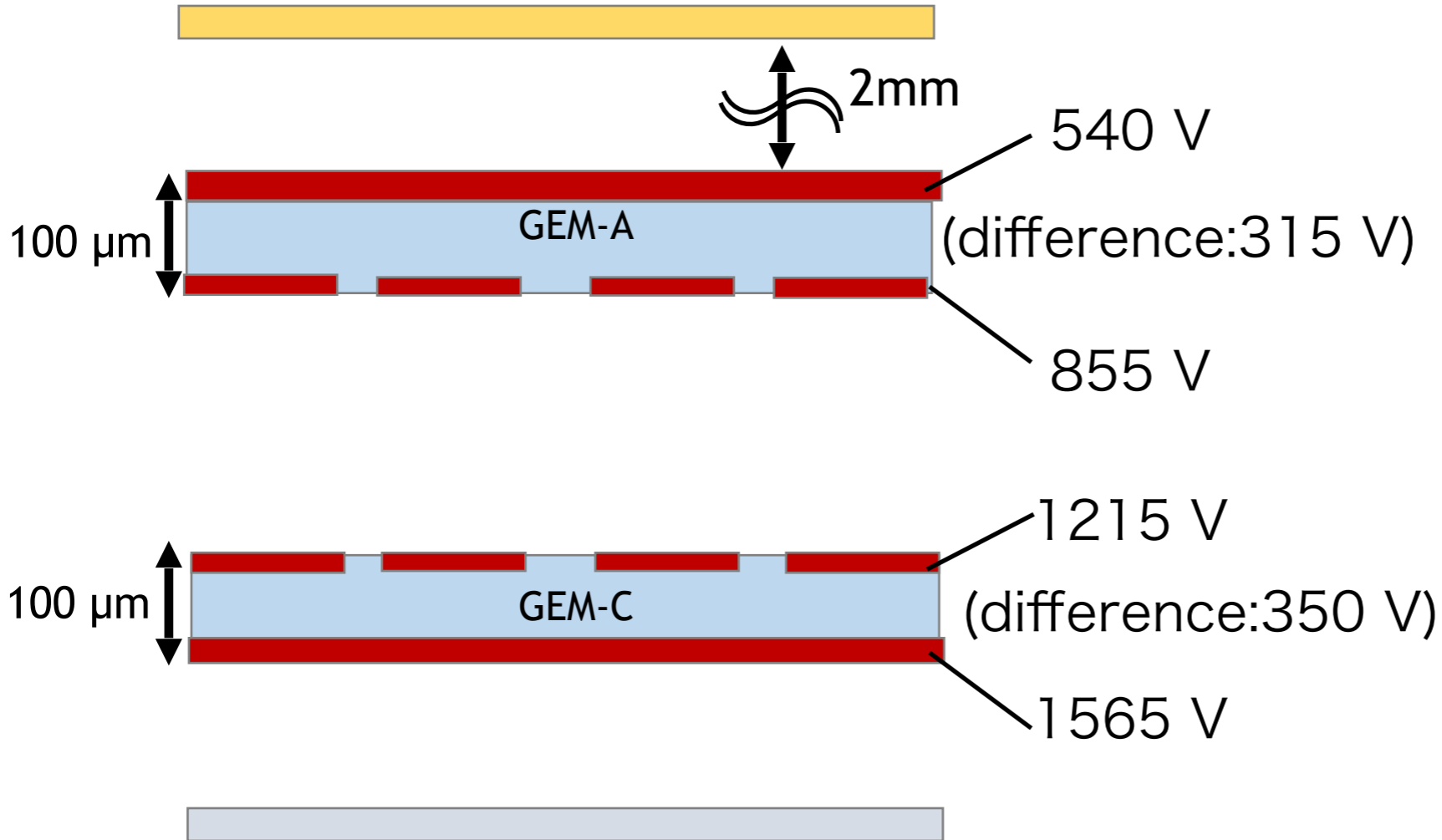
均一性のばらつきは約15%であることが分かった

GEMが均一でないことの原因の解明が課題

Uniformity

~GEMの断面図~

Anode

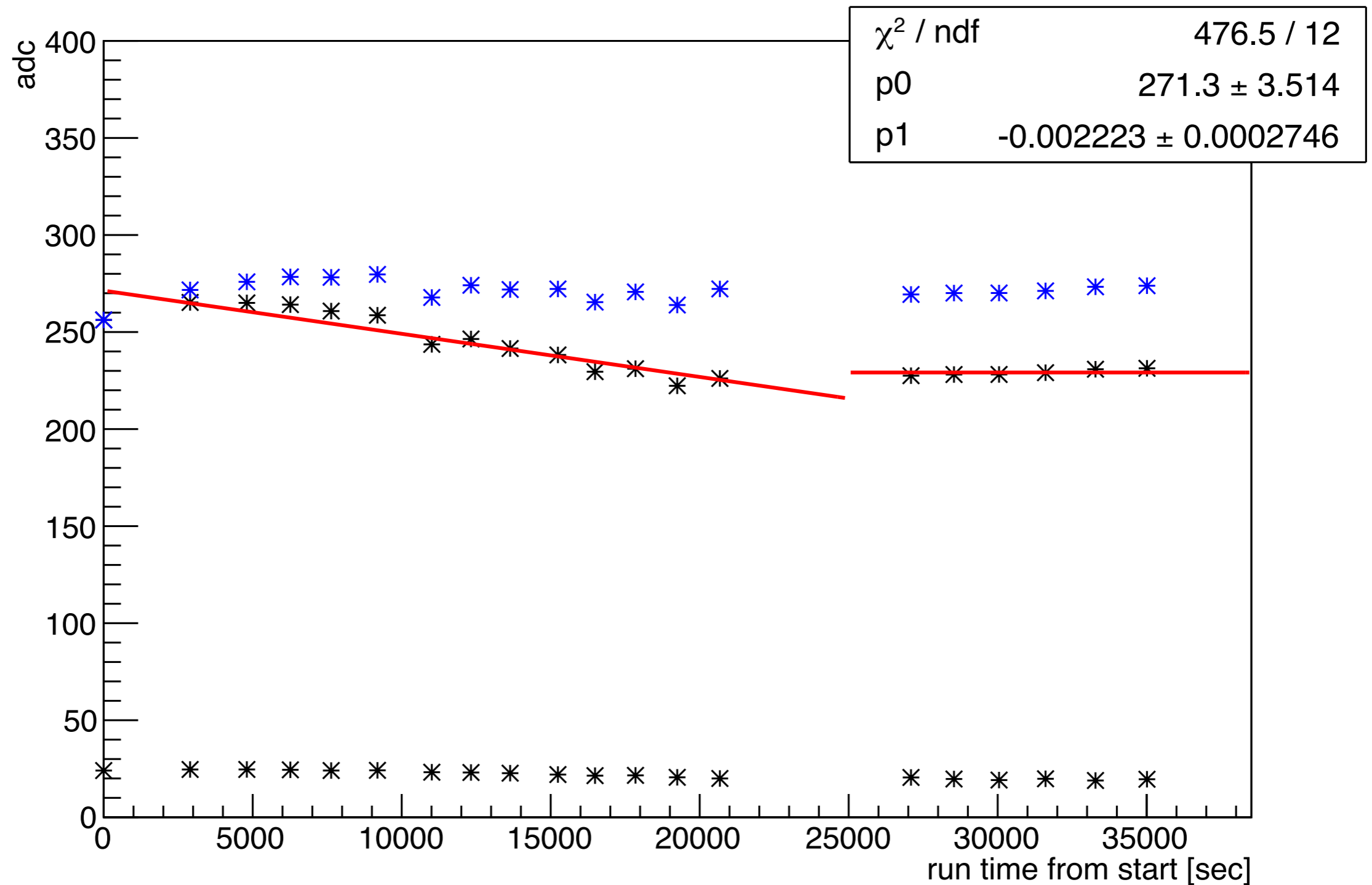


Pressure:1013
Temperature:25
O₂:27.5
H₂O:674->466

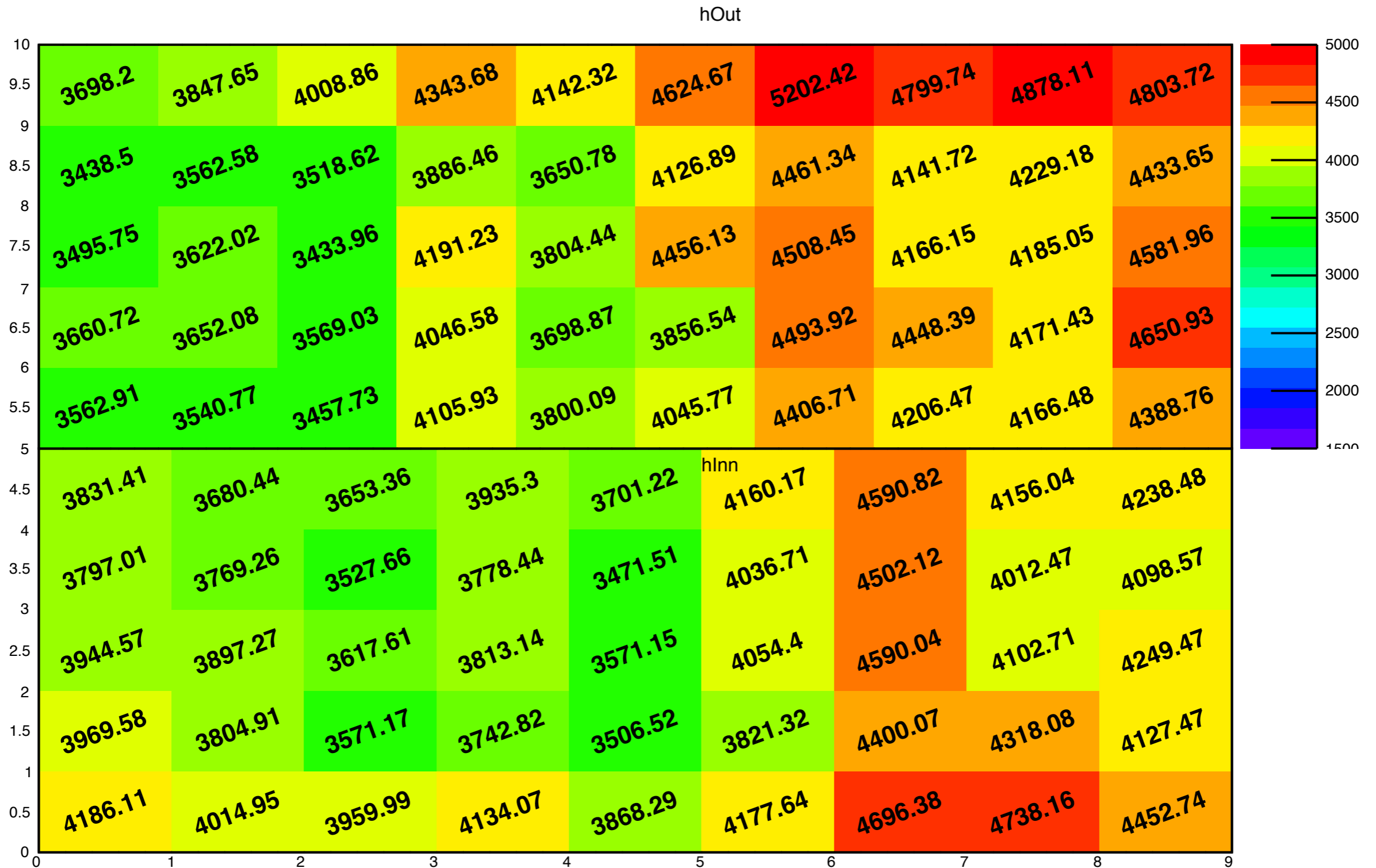
Measurement points

D1	D15	D30	D43	D57	D70	D86	D101	D117	D130	D144	D159
D2	D16	D31	D44	D58	D71	D87	D102	D118	D131	D145	D160
D3	D17	D32	D45	D59	D72	D88	D103	D119	D132	D146	D161
D4	D18	D33	D46	D60	D73	D89	D104	D120	D133	D147	D151
D5	D19	D34	D47	D61	D74	D90	D105	D121	D134	D148	D152
D6	D20	D35	D48	D62	D75	D91	D106	D122	D135	D149	D153
D7	D21	D36	D49	D63	D76	D92	D107	D123	D136	D150	D154
D8	D22	D37	D50	D64	D77	D93	D108	D124	D137	D155	
D9	D23	D38	D51	D65	D78	D94	D109	D125	D138	D156	
D10	D24	D39	D52	D66	D79	D95	D110	D126	D139	D157	
D11	D25	D40	D53	D67	D80	D96	D111	D127	D140	D158	
D12	D26	D41	D54	D68	D81	D97	D112	D128	D141	D85	
D13	D27	D42	D55	D69	D82	D98	D113	D129	D142	D100	
D14	D28	D29	D56	D84	D83	D99	D114	D115	D143	D116	

About correction



Uniformity



Summery

- The gain of GEM pair 3 is about 3500~5000 (difference : $\pm 22\%$)
- The gain of D103~D112 is little higher than others
- I'll conduct research about GEM thickness simulation to describe non uniformity.